การเตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์เร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเคลือบบนพอลิ(เมทิลเมทาคริเลต) สำหรับการขจัดฟืนอลจากน้ำเสีย

นางสาวฐนิสตา เลื่อนลอย

# จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคนิค ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### PREPARATION OF PHOTOCATALYTIC TiO<sub>2</sub> COATED ON POLY(METHYL METHACRYLATE) FOR PHENOL REMOVAL FROM WASTEWATER

Miss. Tanisata Luenloi

# สูนย์วิทยุทรัพยากร

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Program in Chemical Technology Department of Chemical Technology Faculty of Science Chulalongkorn University Academic Year 2010 Copyright of Chulalongkorn University

#### หัวข้ดวิทยานิพนล์

โดย สาขาวิชา **ดาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน**ล์หลัก กาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

การเตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์เร่งปฏิกิริยาเชิงแลงเคลือบบน พอลิ(เมทิลเมทาคริเลต)สำหรับการขจัดพื่นอลจากน้ำเสีย นางสาวฐนิสตา เลื่อนลอย เคมีเทคบิค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์ <mark>จุฬา</mark>ลงกรณ์มหาวิทย<mark>าลัย อนุมัติให้</mark>นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามุ<del>มาบั</del>ญฑิต

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

(ศาสตราจารย์ ดร. สูพจน์ หารหนองบัว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์)

**วก**มาก U. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์)

*นิธุโก*\_\_\_\_\_อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์)

รักม 7 กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. เก็จวลี พฤกษาทร)

📈 กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

(ดร. เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์)

ฐนิสตา เลื่อนลอย : การเตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์เร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเคลือบบน พอลิ(เมทิลเมทาคริเลต)สำหรับการขจัดฟีนอลจากน้ำเสีย (PREPARATION OF PHOTOCATALYTIC TiO<sub>2</sub> COATED ON POLY(METHYL METHACRYLATE) FOR PHENOL REMOVAL FROM WASTEWATER) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์, อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์, 104 หน้า.

งานวิจัยนี้ศึกษาการขจัดฟืนอลโดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงโดยใช้ไทเทเนียมได ออกไซด์เคลือบบนแผ่นพอลิ<mark>เมทิลเมทาค</mark>ริเล<mark>ตโดยเทคนิคการ</mark>จุ่มเคลือบ ศึกษาผลของอัตราส่วน โดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์และจำนวนรอบในการเคลื่อบผิวต่อลักษณะ และประสิทธิภาพของพีล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตใน การขจัดฟื่นอลในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะประกอบด้วยหลอดอัลตราไวโอเล็ต (9 วัตต์/หลอด) จำนวน 15 หลอด แล<mark>ะเวลาในการทำปฏิกิริยา 5 ชั่วโมง โดยใช้สารละลายพื้นอลที่มีความ</mark> เข้มข้นเริ่มต้น 50 พีพีเอ็ม (500 มิลลิลิตร) ศึกษาผลของตัวแปรต่าง ๆ ต่อประสิทธิภาพในการ ขจัดฟีนอลโดยใช้การออกแบบการทด<mark>ลองแบบแฟคทอเรียลส</mark>องระดับ การสลายตัวของฟีนอล ้ขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่ จ<mark>ำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเ</mark>ลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ความเป็นกรด-เบสของสารละลาย<mark>พื้นอล ความเข้ม</mark>ข้นเริ่มต้นของพื้นอล ความเข้มข้นของ กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต อัตราการไหลของออกซิเจน และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา จากผลการทดลองพบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้ จากอัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 3 เคลือบบนพอลิเมทิลเม ทาคริเลต 3 รอบ ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของระบบ คือ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเม ทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 8 แผ่นในสารละลายฟื้นอลด้วยความเข้มข้น เริ่มต้นที่ 50 พีพีเอ็ม ความเป็นกรด-เบสที่ 5 และความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 0.62 โมลาร์ ภายใต้กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตที่ 135 วัตต์และอัตราการไหลของ ออกซิเจนที่ 200 มิลลิลิตรต่อนาที ที่ 30 องศาเซลเซียส พบว่ามีอัตราการสลายตัวของพื้นอล ได้สูงสุดถึง 7.2×10<sup>-3</sup> นาที<sup>-1</sup> (ขจัดฟีนอลได้ 91.4%)

ภาควิชาเคมีเทคนิค	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชาเคมีเทคนิค	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก?ภาก
ปีการศึกษา2553	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม. ม

##5172570723 : MAJOR CHEMICAL TECHNOLOGY KEYWORDS : TITANIUM DIOXIDE / PHOTOCATALYTIC / POLY(METHYL METHACRYLATE) / PHENOL

TANISATA LUENLOI : PREPARATION OF PHOTOCATALYTIC TiO<sub>2</sub> COATED ON POLY(METHYL METHACRYLATE) FOR PHENOL REMOVAL FROM WASTEWATER. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. NAPIDA HINCHIRANAN, Ph.D., THESIS CO-ADVISOR: ASST. PROF. THAMMANOON SREETHAWONG, Ph.D., 104 pp.

This research aims to study the phenol removal via photooxidation catalyzed by using titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>) coated on poly(methyl methacrylate) (PMMA) sheets prepared by dip-coated technique. The effects of mole ratio of acetylacetone (ACAC) to TiO<sub>2</sub> and the number of coating cycle on the characteristics and catalytic efficiency of thin film TiO<sub>2</sub> on PMMA sheets were also investigated. The reaction was carried out in a glass batch reactor equipped with 15 pieces of ultraviolet (UV) lamps (9 watts/lamps) for 5 h. The initial phenol concentration was kept constant at 50 ppm (500 mL). The influence of reaction parameters on the phenol removal efficiency were statistically evaluated by a two-level factorial design experimental. The degradation of phenol depended on several parameters such as the number of TiO2coated on PMMA sheets, pH of phenol solution, initial phenol concentration, H2O2 concentration, power of UV lamp, oxygen flow rate and temperature. The experimental data exhibited that the mole ratio of ACA to TiO<sub>2</sub> at 3 with 3 coating cycles. The optimum conditions were obtained from 8 sheets of TiO2-coated on PMMA sheets in the phenol solution with initial concentration as 50 ppm, 5 of pH value, 0.62 M of H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> concentration. Under UV lamp power at 135 W and 200 ml/min of oxygen flow rate at  $30^{\circ}$ C to reach the degradation rate constant of 7.2×10<sup>-3</sup> min<sup>-1</sup> (phenol removal of 91.4%).

Department :Chemical TechnologyStudent's SignatureTanisataLuchloiField of Study :Chemical TechnologyAdvisor's SignatureHinchirananAcademic Year :2010Co-Advisor's SignatureTotal

### กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้กรุณาให้ คำปรึกษาแนะนำการทำวิจัยตลอดจนคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาเคมีเทคนิคที่ให้คำแนะนำและ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการวิจัยมาตลอด

ขอขอบคุณการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปีโตรเลียม ปีโตรเคมีและ วัสดุขั้นสูง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการทุนวิจัย มหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัญญาเลขที่ MRG-WII525S017 และทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์ ประธานกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. เก็จวลี พฤกษาทรและดร. เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ กรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ ที่กรุณารับเชิญเป็นกรรมการสอบ ตลอดจนให้คำแนะนำ เสนอแนะและความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ขอขอบคุณบุคลากรในภาควิชาเคมีเทคนิคทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกในการใช้ ห้องปฏิบัติการและกรุณาช่วยเหลือพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ และ พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในภาควิชาเคมีเทคนิคและหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ที่ได้ให้ ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ ให้ คำแนะนำ ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

# สารบัญ

	2
หา	นา

	•
บทคัดย่อภาษาไทย	4
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ବ
กิตติกรรมประกาศ	ନ୍ଥ
สารบัญ	I
สารบัญตาราง	ป
สารบัญภาพ	ป

# บทที่

1	บทน้′	n	1
	1.1	ความเป็นมาแล <mark>ะความสำคัญของปัญหา</mark>	1
	1.2	วัตถุประสงค์ของง <mark>า</mark> นวิจัย	2
	1.3	ขอบเขตของงานวิจัย	3
	1.4	ขั้นตอนของงานวิจัย	3
	1.5	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
2	ทฤษม์	ฏิที่เกี่ยวข้อง	5
	2.1	แนวคิดและทฤษฎี	5
	2.2	สมบัติของฟีนอล	7
		2.2.1 ข้อมูลทั่วไป	7
		2.2.2 การใช้งาน	8
		2.2.3 การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	9
		2.2.4 ความเป็นพิษ	9
		2.2.4.1 ความเป็นพิษต่อสัตว์	9
		2.2.4.2 ความเป็นพิษต่อมนุษย์	9
	2.3	สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า	10
	2.4	ไทเทเนียมไดออกไซด์	12
		2.4.1 คำจำกัดความ	12

# สารบัญ (ต่อ)

บทที่				หน้า
		2.4.2	โครงสร้างผลึกและสมบัติ	13
		2.4.3	ลักษณะของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าและความว่องไวของตัวเร่ง	
			ปฏิกิริยาเชิงแสง	16
	2.5	กระบว	มนการเร่งปฏิกิริยาเ <mark>ชิงแสง</mark>	17
		2.5.1	ข้อมูลทั่วไ <mark>ป</mark>	17
		2.5.2	หลักการของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง	18
		2.5.3	กลไกก <mark>ารเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงของ</mark> ฟีนอล	24
	2.6	แสง		25
	2.7	พอลิเม	มทิลเมทาคริเลต	26
	2.8	งานวิจั	ัยที่เกี่ยวข้อง	27
3	วิธีดำ	าเนินการ์	วิจัย	30
	3.1	เครื่องม	มือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย	30
	3.2	สารเครื่	มีที่ใช้	30
	3.3	วิธีการ	ดำเนินงานวิจัย	31
		3.3.1	การเตรียมน้ำเสียตัวอย่าง	32
		3.3.2	การเ <mark>ตรี</mark> ยมผิวแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต	32
		3.3.3	การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์	32
		3.3.4	การทดลองออกซิเดชันเชิงแสงของฟีนอลเร่งปฏิกิริยาด้วยไทเท	
			เนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต	33
		3.3.5	ทดสอบลักษณะสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียม	
			ไดออกไซด์	35
			3.3.5.1 การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์	35
			3.3.5.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	36
			3.3.5.3 เครื่อง UV-Vis spectrophotometer	36
	3.4	การวิเศ	าราะห์ทางสถิติโดยใช้การออกแบบการทดลองแฟกทอเรียล	
		สองระ	ดับ	37

# สารบัญ (ต่อ)

บทที่					หน้า
		3.4.1	ผลตกค้าง	และการตรวจสอบความถูกต้องแบบจำลอง	40
			3.4.1.1	ความสัมพันธ์ของ Normal probability	
				กับผลตกค้าง	41
			3.4.1.2	ความสัมพันธ์ของผลตกค้างกับค่าทำนาย	41
		3.4.2	สมการถด	ถอย	41
4	ผลกา	ารทดลอง	และวิจาร <mark>ณ์</mark>	โผลการทดลอง	42
	4.1	ผลของ	อัตราส่ว <mark>นโ</mark> ด	ายโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์	
		และจำ	นวนรอ <mark>บในเ</mark>	าารเคลือบต่อ <mark>ลักษณะและป</mark> ระสิทธิภาพในการขจัด	
		ฟีนอล.			42
	4.2	<b>ଧ</b> ରଏବଏ	อุณหภูมิในเ	า <mark>ารผาไทเทเนียมได</mark> ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพในการ	
		ขจัดฟีน	ເອລ	2.42.622	46
	4.3	จลนศา	สตร์ของการ	รกำจัดฟี <mark>นอลด้วยออกซิเดชันเชิ</mark> งแสงเร่งปฏิกิริยา	
		ด้วยไทเ	เทเนียมไดอ	อกไซ <mark>ด์เคลือบบนแผ่นพอลิ</mark> เมทิลเมทาคริเลต	47
		4.3.1	ผลของจำ	นวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเท	
			เนียมไดอช	อกไซด์ต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล	48
		4.3.2	ผลข <mark>อง</mark> ค่า	เความเป็นกรด-เบสต่ออัตราการสลายตัวของฟื่นอล	50
		4.3.3	ผลของคว	ามเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลต่ออัตราการสลายตัว	
			ของฟีนอล		53
		4.3.4	ผลของกำ	ลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตต่ออัตราการสลาย	
			ตัวของฟีเ	มอล	54
		4.3.5	ผลของคว	วามเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่ออัตรา	
			การสลาย	เต้วของฟื่นอล	56
		4.3.6	ผลของอัเ	ทราการไหลของแก๊สออกซิเจนต่ออัตราการสลายตัว	
			ของฟีนอ	ລ	58
		4.3.7	ผลของอุเ	ณหภูมิในการทำปฏิกิริยาต่ออัตราการสลายตัว	
			ของฟีนค	ล	59

### สารบัญ (ต่อ)

บทที่			หน้า
4	4.4	การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล	
		แบบสองระดับต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟื่นอล	61
		4.4.1 สมการถดถอย	66
		4.4.2 ผลตกค้างแ <mark>ละการตรวจสอบความถูกต้</mark> อง	67
2	4.5	ผลของปัจจัยต่าง ๆ <mark>ต่อระดับก</mark> ารขจัดขอ <mark>งฟีนอล</mark>	70
2	4.6	การทดสอบจำนว <mark>นรอบการใช้งานของแผ่นพอลิเมทิล</mark> เมทาคริเลต	
		เคลือบด้วยไทเทเ <mark>นียมไดออกไซด์และจำนวนรอบของก</mark> ระบวนการ	
		ออกซิเดชันเชิงแสงในการขจัดฟื้นอล	72
5	สรุป	ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ	74
	5.1	สรุปผลการวิจัย	74
	5.2	ข้อเสนอแนะ	78
รายการ	ข้างอิง	1	79
ภาคผน	วก		81
	ภาค	ผนวก ก สเปกตรัมการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเล็ต	82
	ภาค	ผนวก ข การคำนวณ	83
	ภาค	ผนวก ค การออ <mark>ก</mark> แบบเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ	88
	ภาค	ผนวก ง ประสิทธิภาพการขจัดฟื่นอล	89
ประวัติผู้	ู้เขียน	วิทยานิพนธ์	104

# 

# สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.1	สมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของฟีนอล	8
2.2	ตำแหน่งของแถบอิเล็กตรอนของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าบางชนิด	12
2.3	สมบัติของรูไทล์และอนาเทส	14
2.4	สารประกอบที่สามารถก <mark>ำจัดด้วยปฏิกิริยาเชิงแสงโด</mark> ยใช้ไทเทเนียม	
	ออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิร <mark>ิยา</mark>	23
3.1	ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาการกำจัดฟื่นอลด้วยกระบวนการออกซิเดชัน	
	เซิงแสงเร่งปฏิกิริย <mark>าด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เคลื</mark> อบบน <mark>พ</mark> อลิเมทิล	
	เมทาคริเลต	35
3.2	สภาวะของการออ <mark>กแบบ 2<sup>4</sup> ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดฟีนอล</mark>	
	ด้วยการเร่งปฏิกิริย <mark>าเชิงแสง</mark>	37
3.3	การวิเคราะห์ความแ <mark>ปรปรวนสำหรับการออ</mark> กแบบ 2⁴	39
4.1	ผลของอัตราส่วนโดยโม <mark>ลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนี</mark> ยมไดออกไซด์	
	และจำนวนรอบในการเคลือ <mark>บต่อประสิทธิภาพใน</mark> การกำจัดฟีนอล	44
4.2	ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอยู่จริงบนผิวของพอลิเมทิลเมทาคริเลต	45
4.3	อัตราส่วนโดยน้ำหนักของสัณฐานแบบอนาเทสต่อรูไทล์ที่อุณหภูมิการเผา	
	ไทเทเนียมไดออก <mark>ไซ</mark> ด์แตกต่างกัน	47
4.4	ผลการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบสองระดับต่อประสิทธิ	
	ภาพในการกำจัดฟื่นอล	62
4.5	การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล	
	แบบสองระดับจำนวน 4 ปัจจัย	64
4.6	การคำนวณค่าประมาณปัจจัย ค่าประมาณสัมประสิทธิ์และค่าคลาด	
	เคลื่อนมาตรฐานของการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลต่อ	
	ประสิทธิภาพในการกำจัดฟีนอล	65
4.7	ค่าจริง ค่าทำนายและผลตกค้างต่อประสิทธิภาพในการกำจัดฟื่นอล	68

# สารบัญภาพ

ภาข	งที่		หน้า
	2.1	โครงสร้างของฟื่นอล	7
	2.2	ฟีนอลในธรรมชาติ	7
	2.3	โครงสร้างของพลังงานช่องว่าง <mark>อิเล็กตรอ</mark> น	11
	2.4	โครงสร้างผลึกของอนาเ <mark>ทส รูไทล์ และบรูคไทล์</mark>	13
	2.5	แถบของสารกึ่งตัวน <mark>ำไฟฟ้าด้วยพ</mark> ลังงานศัก <mark>ย์ย้อนกลับ</mark>	17
	2.6	กระบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเ <mark>ด</mark> ชันเชิงแส <mark>งของตัวเร่งป</mark> ฏิกิริยาเชิงแสง	19
	2.7	กลไกการเกิดออกซิเ <mark>ด</mark> ชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของฟืนอล	24
	2.8	สเปกตรัมของแสง	25
	2.9	สูตรโครงสร้างขอ <mark>งพ</mark> อลิเมทิลเมทาค <mark>ริเล</mark> ต	26
	3.1	ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิง <mark>แสงไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิล</mark>	
		เมทาคริเลต	33
	3.2	เครื่องปฏิกรณ์สำหรับก <mark>ารกำจัดฟีนอลด้วยกระบวนก</mark> ารออกซิเดชันเชิง	
		แสงเร่งปฏิกิริยาด้วยไทเทเน <mark>ียมไดออกไซด์เคลือ</mark> บบนแผ่นพอลิเมทิล	
		เมทาคริเลต	34
	4.1	ภาพพื้นผิวที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของฟิล์ม	
		บางไทเทเนียมได <mark>อ</mark> อกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่อัตราส่วน	
		โดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์	42
	4.2	ภาพพื้นผิวที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของฟิล์ม	
		บางไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่จำนวนรอบ	
		ในการเคลือบ	43
	4.3	ผลของอุณหภูมิในการเผาต่อรูปแบบ XRD ของอนุภาค	
		ไทเทเนียมไดออกไซด์	46
	4.4	ผลของจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อ	
		ค่าคงที่ปรากฏอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงในการกำจัดฟีนอล	49
	4.5	ผลของค่าความเป็นกรด-เบสต่อค่าคงที่ปรากฏอัตราการเกิดปฏิกิริยา	
		ออกซิเดชันเชิงแสงในการกำจัดฟื่นอล	51

# สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
4.6	ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลต่อค่าคงที่ปรากฏอัตราการเกิดปฏิกิริยา	
	ออกซิเดชันเชิงแสงในการกำจัดฟื่นอล	54
4.7	ผลของกำลังของหลอดยูวีต่อค่ <mark>าคงที่ปรากฏอั</mark> ตราการเกิดปฏิกิริยา	
	ออกซิเดชันเชิงแสงในการก <mark>ำจัดฟีนอ</mark> ล	55
4.8	ผลของความเข้มข้นข <mark>องไฮโดรเจ</mark> นเปอร์ออกไซด์ต่อค่าคงที่ปรากฏอัตราการ	
	เกิดปฏิกิริยาออกซิเ <mark>ดชันเชิงแสงในการกำจัดฟีนอล</mark>	57
4.9	ผลของอัตราการไห <mark>ลของแก๊สออกซิเจนต่อค่าคงที่ปรากฏ</mark> อัตราการเกิดปฏิกิริยา	
	ออกซิเดชันเชิงแส <mark>งในการกำจัดฟีนอล</mark>	59
4.10	ผลของอุณหภูมิใ <mark>นการทำปฏิกิริยาต่อค่าคงที่ปรากฏอัตรา</mark> การเกิดปฏิกิริยา	
	ออกซิเดชันเชิงแสงใ <mark>นการ</mark> กำจัดฟ <mark>ีนอล</mark>	60
4.11	ผลการคำนวณตามสมการ Arrhenius Equation	60
4.12	ความสัมพันธ์ระหว่าง Normal probability กับค่าประมาณปัจจัยต่อ	
	ประสิทธิภาพในการกำจัดฟ <mark>ีนอล</mark>	63
4.13	ความสัมพันธ์ระหว่าง Normal probability กับผลตกค้างต่อประสิทธิภาพ	
	ในการกำจัดฟืนอล	69
4.14	ความสัมพันธ์ระหว่างผลตกค้างกับค่าทำนายต่อประสิทธิภาพในการกำจัด	
	ฟื่นอล	69
4.15	ผลการคำนวณจากสมการถดถอยกับข้อมูลจากการทดลอง	71
4.16	จำนวนรอบในการใช้งานของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเท	
	เนียมไดออกไซด์ต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน	
	เชิงแสงในการกำจัดฟีนอล	72
4.17	จำนวนรอบของกระบวนการออกซิเดชันเชิงแสงในการลดปริมาณฟืนอล	73

### บทที่ 1

#### บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ฟื่นอลเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยวงเบนซึ่นและหมู่ไฮดรอกซิล ฟื่นอลผลิต จากกระบวนการออกซิเดชันบางส่วน (partial oxidation) ของเบนซีน หรือปฏิกิริยารีดักชันของกรด เบนโซอิกโดยกระบวนการคิวมี<mark>น หรือโดยกระบวนการ Ra</mark>sching Process นอกจากนี้ยังพบใน ้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออก<mark>ซิเดชันของถ่านหิน</mark> (Chiou และคณะ,2008) ฟีนอลนำไปใช้ประโยชน์ ้สำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมยา พลาสติก ปุ๋ย ระเบิด สี สิ่งทอ ยาง และ สารป้องกันการเสื่อมสภาพ เป็นต้น ฟีนอลยังเป็นสารตั้งต้นสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติกโดยใช้ ในการผลิตบิสฟีนอล เอ (bisphenol A, BPA) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอีพ็อกซีเรซินและพอลิ คาร์บอเนตเรซิน อย่างไรก็ตามฟีนอลมีโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากฟีนอลสามารถ ้ซึมผ่านผิวหนังได้อย่างรวดเร็วมาก ทำให้ผิวหนังไหม้ได้ ฟีนอล 1 กรัมสามารถทำให้บุคคลที่ได้รับ ถึงแก่ชีวิต จากกฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งออกโดย The Environmental Protection Agency ระบุว่า ้ปริมาณฟื่นอลในแหล่งน้ำต้อง<mark>ควบคุมให้น้อยกว่า 1 ม</mark>ิลลิกรัมต่อลิตร (Baker และคณะ, 1978) ้ดังนั้นอุตสาหกรรมใดที่ใช้ฟีนอลใ<mark>นกระบวนการผลิตมีค</mark>วามจำเป็นที่ต้องมีระบบบำบัดหรือขจัด สารประกอบฟีนอล โดยทั่วไปสามารถขจัดฟีนอลได้หลายวิธี เช่น กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ ธรรมดา ซึ่งวิธีนี้ไม่สามารถขจัดสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Haggblom และคณะ, 1998, Dorn และคณะ, 1988) กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพเป็นกระบวนการที่ขจัดได้ช้า ต้อง ควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และยัง มีปัญหาในการขจัดกากตะกอนที่เกิดขึ้นอีกด้วย (Shibaeva และคณะ, 1969, Moza และคณะ, 1988) นอกจากนี้การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดูเหมือนจะใช้ได้ผลมากที่สุดก็ ้จำเป็นต้องมีระบบภายหลังการดูดซับเพื่อขจัดฟืนอลและนำถ่านกัมมันต์หมุนเวียนกลับมาใช้อีก ้ครั้งหนึ่ง (Juan และคณะ, 1984) ดังนั้นเพื่อให้ฟื้นอลถูกขจัดได้อย่างสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องหาวิธีที่ มีประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียที่มีฟีนอลปนเปื้อนเหล่านี้ออกสู่แหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเซิงแสง (photocatalytic) เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถย่อย สลายสารประกอบอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียได้ โดยอาศัยสารที่มีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ ไฟฟ้า (semiconductor) เพื่อให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง สร้างส่วนที่เป็นแหล่งการเกิด ้ออกซิเดชันเพื่อสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ (Baker และคณะ. 1978) โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแลงที่นิยมนำมาใช้ คือ ไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide, TiO<sub>2</sub>) แต่เนื่องจากไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ใช้กันโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นผงขนาดนาโน จึงยากต่อ การแยกไทเทเนียมไดออกไซด์ออกจากน้ำเสียภายหลังกระบวนการขจัดฟีนอลสิ้นสุดลง ดังนั้นจึงมี ความจำเป็นที่จะต้องฝังไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับเพื่อให้ง่ายต่อการแยกภายหลังเสร็จสิ้น ปฏิกิริยาออกซิเดชัน แต่ตัวรองรับต้องสามารถยอมให้แสงผ่านได้เพื่อให้ไทเทเนียมไดออกไซด์ สามารถรับแสงและทำงานต่อไปได้ เทคนิคการฝังไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับของแข็ง (impreganation technique) <mark>ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาหลายวิธี ไ</mark>ด้แก่ การจุ่มเคลือบ (dip coating) เทคนิคโซล-เจล (sol-gel) การเคลือบด้วยสเปรย์ (spray coating) และเทคนิคการพ่น (sputtering) (Hosseini และคณะ, 2007) โดยตัวรองรับโปร่งใสที่นำมาใช้งาน ได้แก่ เม็ดแก้ว (glass beads) (Karches และคณะ, 2002) หลอดแก้ว (glass tubes) (Lee และคณะ, 2002) และ ไฟเบอร์กลาส (fiber gl<mark>as</mark>s) (Horikoshi และคณะ, 2002) อย่างไรก็ตามการใช้แก้วอาจไม่ ้เหมาะสมในการเป็นตัวรอ<mark>ง</mark>รับไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับบางเครื่องปฏิกรณ์ เนื่องจากแก้วเป็น ้วัสดุเปราะ อาจเกิดความเสีย<mark>หายได้เมื่อรับแรงกระแทกหากน</mark>ำไปใช้ในเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวน หรือฟลูอิไดซ์เบด (fluidized bed) นอ<mark>กจากนี้แก้วยั</mark>งมีคว<mark>าม</mark>หนาแน่นมาก ทำให้มีน้ำหนักสูงจึงไม่ ้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ที่เบดต้องมีการเคลื่อนที่ได้ ดังนั้นจึงสนใจที่จะนำพอลิ เมอร์โปร่งแสงมาใช้เป็นตัวรองรับสำหรับไทเทเนียมไดออกไซด์ ตัวรองรับที่ใช้ คือ พอลิเมทิลเม ทาคริเลตซึ่งมีข้อดี เช่น ยอมให้แสงผ่านได้ถึง 92% มีน้ำหนักเบา และมีความต้านทานต่อ สิ่งแวดล้อมได้ดี (ปรีชา พหลเทพ, 2549)

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจนำไทเทเนียมไดออกไซด์ไปเคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริ เลตเพื่อใช้ในการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการขจัดสารประกอบฟืนอลออกจากน้ำเสีย ก่อนที่จะ ปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสะสมหรือการอุดตัน ภายในเครื่องมือ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแยกอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ ออกภายหลังการใช้งาน

### 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1. เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับพอลิเมทิลเมทาคริเลต
- ศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ บนตัวรองรับพอลิเมทิลเมทาคริเลตในการขจัดฟีนอลจากน้ำเสีย

#### 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

- ศึกษาการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับพอลิเมทิลเม ทาคริเลตโดยเทคนิคการจุ่มเคลือบ (Yang และคณะ, 2006) โดยในงานวิจัยเลือกใช้ ไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดการค้า Degussa P-25
- ศึกษาผลของอัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตน (acetylacetone, ACA) ต่อไทเทเนียม ไดออกไซด์ (ACA/TiO<sub>2</sub>) จำนวนครั้งในการเคลือบ และอุณหภูมิในการเผาตัวเร่งปฏิกิริยา (calcination temperature) ต่อลักษณะของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบบน ผิวของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต
- สร้างเครื่องปฏิกรณ์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเพื่อสลายฟีนอล ในน้ำเสียจำลอง
- ศึกษาผลของตัวแปรต่าง ๆ ในการเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริ เลตต่อสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง
- 5. ศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเชิงแสงต่อประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลในน้ำเสียจำลอง ได้แก่ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ค่าความเป็น กรด-เบส ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กำลัง ของหลอดอัลตราไวโอเล็ต อัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยา และการนำตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่

### 1.4 ขั้นตอนการวิจัย

- 1. ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เตรียมอุปกรณ์และสารเคมีต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทดลอง
- 2. การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับพอลิเมทิลเมทาคริเลต
- ทดสอบลักษณะสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับพอลิเมทิลเม ทาคริเลต
- สร้างเครื่องปฏิกรณ์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่เตรียมได้ในการ สลายสารละลายฟีนอล
- ศึกษาผลของตัวแปรต่าง ๆ ต่อประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้ในการสลายฟีนอล โดยวัดปริมาณฟีนอลคงเหลือในน้ำเสียจำลองด้วยเครื่อง UV-visible spectrometer (UVvis)

6. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล และเขียนวิทยานิพนธ์

### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเพื่อขจัดฟีนอลที่ ปนเปื้อนในน้ำเสียด้วยกระบวนการออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
- ได้ภาวะการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีฟื้นอลปนเปื้อน



# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 แนวคิดและทฤษฎี

ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ้สารประกอบฟืนอลในน้ำก่อให้เกิดปัญ<mark>หาด้านสิ่งแวด</mark>ล้อมอย่างมาก แหล่งที่มาที่สำคัญของฟืนอล ้คือ น้ำเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี เช่น อุตสาหกรรมยา พลาสติก ปุ๋ย ระเบิด ้สี สิ่งทอ ยาง และสารป้องกันการเสื่อมสภาพ เป็นต้น ฟีนอลยังเป็นสารตั้งต้นสำคัญใน อุตสาหกรรมพลาสติกโดยใช้ในการผลิตบิสฟีนอล เอ (bisphenol A, BPA) อาจรั่วไหลมากับน้ำ ้เสีย ดังนั้นของเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต้องผ่านการบำบัดที่เหมาะสมก่อน ้ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากฟีนอลเป็นสารประกอบที่มีความเสถียรและละลายน้ำได้ดี จึง ส่งผลให้ยากต่อการขจัดฟื่นอลในน้ำทิ้งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมต้องควบคุมให้น้อย กว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร (Baker และคณะ, 1978) โดยทั่วไปสามารถขจัดฟื่นอลได้หลายวิธี เช่น ้กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบธรรมดา ซึ่งวิธีนี้ไม่สามารถขจัดสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Haggblom และคณะ, 1998, Dorn และคณะ, 1988) กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพเป็น กระบวนการที่ขจัดได้ช้า ต้องคว<mark>บคุมค่าความเป็นกรด</mark>-ด่าง และอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการ เจริณเติบโตของแบคทีเรีย และยังมีปัญหาในการขจัดกากตะกอนที่เกิดขึ้นอีกด้วย (Shibaeva และ คณะ, 1969, Moza และคณะ, 1988) นอกจากนี้การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดู ้เหมือนจะใช้ได้ผลมากที่สุดก็จำเป็นต้องมีระบบภายหลังการดูดซับเพื่อขจัดฟืนอลและนำถ่านกัม มันต์หมุนเวียนกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง (Juan และคณะ, 1984) การขจัดฟืนอลด้วยปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสง (photooxidation) เป็นวิธีการที่มีราคาไม่สูงและได้รับความสนใจจากนักวิจัย ้อย่างมาก วิธีการนี้จึงเป็นวิธีการที่มีประโยชน์มากในการแก้ไขปัณหาการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม (Fujishima และคณะ, 2000) การใช้สารกึ่งตัวนำไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ้ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมมากที่สุดในการขจัดสารอินทรีย์ เพราะไทเทเนียมไดออกไซด์มีความเสถียรทางกายภาพและเคมี เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความ ว่องไวสูง มีความสามารถในการออกซิไดซ์มาก ไม่มีพิษ และราคาถูก (Hu และคณะ, 2005)

นักวิจัยจำนวนมากทำการศึกษาเกี่ยวกับการขจัดฟืนอลด้วยปฏิกิริยาเชิงแสงใน สารละลายที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์แขวนลอยอยู่ภายใต้แสงสว่างที่ใกล้เคียงกับแสงอัลตราไวโอ เล็ต และมีอากาศไหลผ่านได้ การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแบบจำลองของแลง

เมียร์-ฮินเซลวูดด์ (Langmuir-Hinshelwood model) โดยอธิบายถึงลักษณะของปฏิกิริยาเกี่ยวกับ อัตราเร็วในการขจัดฟื้นอลในรูปของการหายไปของฟื้นอลหรือการเกิดขึ้นของก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ชี้ให้เห็นว่าปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารอินทรีย์ที่ เป็นของเสีย ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเข้มของแสงอัลตราไวโอเล็ต และความเข้มข้นของประจุที่ เป็นกับดักของอิเล็กตรอนและหลุมเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่ออัตราการกำจัดฟืนอลด้วยไทเทเนียมได ออกไซด์ (Chiou และคณะ, 2007) อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยก่อนหน้านี้หลายงานวิจัยใช้ผง ้ไทเทเนียมไดออกไซด์แขวนลอยอยู่ในน้ำที่มีสารอินทรีย์โดยตรง (Cheng และคณะ, 1995, Hermann. 1999) แต่เนื่องจา<mark>กการใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์มีข้อเสีย คือ ต้องแยกผงไทเทเนียม</mark> ใดคอกไซด์หลังจากขบวนก<mark>ารบำบัดน้ำเส</mark>ร็จสิ้นแล้ว เนื่องจากผงไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถติด อยู่ที่ผิวของภาชนะหรืออุปกรณ์ เช่น แก้ว ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งถ้าปล่อยให้สารแขวนลอยของ ้ไทเทเนียมไดออกไซด์นี้แห้งติดอยู่บนเครื่องแก้วจะขจัดออกได้ยาก คราบของไทเทเนียมไดออกไซด์ ้ที่ติดอยู่ในภาชนะมีลักษณะเป็นฟิล์มเมื่อแห้งจะติดอยู่คล้ายกาว ไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำ นอกจากนี้ยังมีข้อเสียของการใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์โดยตรงอื่น ๆ อีก จึงมีการศึกษาเพื่อ พัฒนาการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงด้วยเทคนิคใหม่ ได้แก่ การยึดผงไทเทเนียมไดออกไซด์ไว้ กับตัวรองรับ เช่น เม็ดแก้ว (Karches และคณะ, 2002) หลอดแก้ว (Lee และคณะ, 2002) และไฟ เบอร์กลาส (Horikoshi และคณะ, 2002) แต่ยังคงมีข้อจำกัด คือ แก้วเป็นวัสดุเปราะ อาจเกิด ความเสียหายได้เมื่อรับแรงกระแทกหากนำไปใช้ในถังกวน หรือฟลูอิไดซ์เบด นอกจากนี้แก้วยังมี ความหนาแน่นมาก ทำให้มีน้ำหนักสูงจึงไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ที่มีเบด เคลื่อนที่ได้ ดังนั้นการหาวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความใสในการทำเป็นตัวรองรับให้กับตัวเร่ง ปฏิกิริยาเชิงแสง และการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของตัวเร่งปฏิกิริยาต้องมีความสามารถในการรับและ ยอมให้แสงผ่านทะลุเพื่อให้มีความว่องไวต่อการทำปฏิกิริยาเชิงแสงได้ดี

จากงานวิจัยของ Hu และ Yuan (2006) พบว่าการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ บนพอลิเมอร์ ได้แก่ แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยซิลิกอน ออกไซด์ และยางซิลิโคนเคลือบด้วยซิลิกอนออกไซด์ที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้เทคนิคการจุ่มเคลือบ (dip-coating process) มีประสิทธิภาพดีในการสลาย Brilliant red dye X-3B ในน้ำภายใต้ภาวะ ที่มีการเป่าฟองอากาศ นอกจากนี้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มีข้อดี เช่น เกิดปฏิกิริยาอย่าง รวดเร็ว ราคาถูก เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม และทำงานได้ที่อุณหภูมิต่ำ **2.2 สมบัติของฟีนอล** (กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542)

### 2.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ฟื้นอลเป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีและเป็นสารธรรมชาติ ฟื้นอลเป็นผลึกไม่มีสีหรือสีขาว มีสูตร โมเลกุล คือ C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH แสดงโครงสร้างดังรูปที่ 2.1 จึงทำให้สมบัติส่วนใหญ่ของฟื้นอลแตกต่างจาก สารพวกแอลกอฮอล์ กรณีที่ฟื้นอลไม่บริสุทธิ์จะมีสีชมพูอ่อน ๆ มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ดูดความชื้น ละลายน้ำได้ดี สารละลายที่ได้มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน จึงมีชื่อเรียกที่รู้จักกันทั่วไปว่ากรดคาร์โบลิก (carbolic acid) อนุพันธ์ของฟื้นอลส่วนมากมีสี ขณะที่ตัวมันเองไม่มีสี สามารถพบฟื้นอลใน ธรรมชาติได้ดังรูปที่ 2.2 สมบัติทางเคมีและกายภาพของฟื้นอลแสดงดังตารางที่ 2.1



**รูปที่ 2.1** โครงสร้างของฟื่นอล



**รูปที่ 2.2** ฟืนอลในธรรมชาติ (Clark, 2004)

สมบัติ	ค่า
рН	6
น้ำหนักโมเลกุล	94.11
จุดหลอมเหลว ( <mark>องศาเซลเซียส)</mark>	40.85
จุดเดือด ( <mark>องศาเซลเซี</mark> ยส)	182
จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส)	
ถ้วยเปิด (Open cup)	85
ถ้วยปิด (Closed cup)	79
อุณหภูมิติดไฟได้เอง (องศาเซลเซียส)	715
ช่วงคว <mark>า</mark> มเข้มข้นติดไฟได้ (%)	3-10
ความดัน <mark>ไอ</mark> (มิลลิปรอท) ที่ 25 องศาเซลเซียส	0.3513
การละลาย <mark>น้ำ (กรัม/ลิตร) ที่ 16 องศาเซ</mark> ลเซียส	93
ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)	3.24
ความถ่วงจำเพาะ	1.071
ดัชนีหักเหแสง (ที่ 41 องศาเซลเซียส)	1.5408

**ตารางที่ 2**.1 สมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของฟีนอล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม, 2542)

### 2.2.2 การใช้งาน

- ฟีนอลใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ (disinfectant) โดยใช้เป็นสารละลายเดี่ยวหรือผสมกับยา ฆ่าเชื้อตัวอื่น ฟีนอลมีฤทธิ์เป็น bacteriostatic ที่ความเข้มข้นประมาณ 0.2% มี ฤทธิ์เป็น bacteriocide ที่ความเข้มข้นมากกว่า 1% และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อราได้ที่ ความเข้มข้นมากกว่า 1.3% ฟีนอลยังใช้เป็นสารมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อชนิดต่าง ๆ โดยวัดเป็นค่า phenol coefficient
- ใช้ในการผลิตสารเคมีอันตรายหลายชนิด เช่น ครีซอล (cresols) ไซเลนอล (xylenols) กรดซาลิไซลิก (salicylic acid) อะนิลีน (aniline) และฟีนอลิกเรซิน (phenolic resins)

 ใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์หลายชนิด ได้แก่ สารตั้ง ต้นในการผลิตสารประกอบฟีนอลิกเรซิน ในลอน และเส้นใยสังเคราะห์

### 2.2.3 การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

- อุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตและการใช้ฟีนอลเพื่อผลิตสารเคมีชนิดต่าง ๆ
- บ้านเรือนและห้องปฏิบัติการจากการใช้ฟีนอลเป็นสารฆ่าเชื้อ
- ไอเสียรถยนต์มีฟีนอลผสมอยู่เล็กน้อยที่ความเข้มข้น 1.2-7.7 มิลลิลิตรต่อลูกบาศก์ เมตร
- การย่อยสลายของเบนซีนโดยทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล (hydroxyl radical) ในอากาศ

### 2.2.4 ความเป็น<mark>พิ</mark>ษ

### 2.2.4.1 ความ<mark>เป็นพิษต่อสัตว์</mark>

ฟื้นอลจัดเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษปานกลาง มีค่า LD<sub>50</sub> ต่อหนูเมื่อได้รับสารนี้ โดยการฉีดเข้าช่องท้องเท่ากับ 127-223 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ความเป็นพิษอย่าง เฉียบพลันที่เกิดกับสัตว์ทดลองเมื่อมีการฉีดฟื้นอลเข้าสู่ช่องท้อง จะแสดงอาการทาง ประสาทและกล้ามเนื้อไวต่อการกระตุ้นมากเกินไป (neuromuscular hyper-excitability) อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นในระยะแรกและกลับช้าลงและไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอ ความดันโลหิตสูงเล็กน้อยในตอนแรกซึ่งต่อมาจะลดลงอย่างมาก น้ำลายไหล หายใจขัด และอุณหภูมิของร่างกายลดลง นอกจากนี้ฟื้นอลยังมีผลกระทบต่อการทำงานของปอด และเส้นใยประสาท ทำลายเนื้อเยื่อของตับ ไต และต่อมไทมัส (thymus gland) และยับยั้ง การตอบสนองของรูม่านตาต่อแสงและรูม่านตาดำหดเล็กผิดปกติ

2.2.4.2 ความเป็นพิษต่อมนุษย์

เมื่อฟีนอลเข้าสู่ร่างกายในปริมาณความเข้มข้นเล็กน้อย ทำให้เกิดความเป็นพิษ ต่อระบบการทำงานของร่างกายได้ การเสียชีวิตของมนุษย์ที่ได้รับฟีนอลโดยการกินใน ปริมาณเพียง 1 กรัม อาจเสียชีวิตได้ ส่วนการได้รับการสัมผัสทางผิวหนังจากการหกรด ของสารละลายฟีนอลที่บริเวณแก้ม หนังศีรษะ สะโพก ต้นขา และถุงอัณฑะอาจทำให้

ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้เช่นกัน ในกรณีของความเป็นพิษเฉียบพลันที่เกิดจากการได้รับฟืนอล ้โดยการรับประทาน การสูดดมหรือ สัมผัสทางผิวหนัง เนื่องจากฟื่นอลมีฤทธิ์กัดกร่อน เนื้อเยื่อทำให้เกิดแผลไหม้ในบริเวณที่ได้รับสัมผัสโดยตรง เช่น ช่องปาก หลอดอาหาร โดยหากเข้าตาอาจทำให้มีอาการตาสู้แสงไม่ได้ และผิวหนัง ตา กระเพาะคาหาร (photophobia) กระจกตาเป็นแผลหรืออาจถึงกับตาบอดได้ ฟีนอลสามารถถูกดูดซึมผ่าน ้ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วและอาจทำให้เสียชีวิตภายในเวลา 10 นาที ในกรณีของความเป็น พิษเรื้อรังที่เกิดจากการได้รับฟืนอล เนื่องจากใช้ฟืนอลในการรักษาโรคและการผ่าตัด การ ได้รับฟีนอลเข้าสู่ร่าง<mark>กายซ้ำหลา</mark>ยครั้งในปริ<mark>มาณมาก</mark>ทำให้อาเจียน กลื่นอาหารลำบาก ้น้ำลายไหล ท้องเสีย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด ปวดศีรษะ เป็นลม มึนงง อารมณ์ แปรปรวน ตับและไตถูกทำลาย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปัสสาวะมีสีคล้ำ ผิวหนัง แตกเป็นแผล และคาจมีสีผิวผิดปกติ นคกจากนั้นการใช้สเปรย์หรือยาคมที่มีส่วนผสม ของฟีนอลอาจทำให้มีอาการเจ็บคอบ่อย ๆ

### 2.3 สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า (Hoffmann และคณะ, 1995)

สารกึ่งตัวนำไฟฟ้าเป็นสารที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างฉนวน กับตัวนำไฟฟ้า สารกึ่งตัวนำไฟฟ้ามีแถบอิเล็กตรอนซึ่งหาได้จากความเป็นผลึกของสาร สารกึ่ง ตัวนำไฟฟ้าที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงอยู่ในรูปโลหะออกไซด์หรือซัลไฟด์ เช่น ไทเทเนียมได ออกไซด์ (titanium dioxide, TiO<sub>2</sub>) แคดเมียมซัลไฟด์ (cadmium sulfide, CdS) และซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide, ZnO) การกระจายตัวของพลังงานอิเล็กตรอนถูกอธิบายโดยใช้ระดับเฟร์มี (Fermi level) ซึ่งเป็นระดับพลังงานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของ อิเล็กตรอน ที่อุณหภูมิเท่ากับศูนย์นั้นอิเล็กตรอนมีพลังงานต่ำกว่าระดับเฟร์มีแต่ที่อุณหภูมิไม่ เท่ากับศูนย์ ระดับพลังงานจะถูกสุ่มและอิเล็กตรอนจะมีพลังงานสูงกว่าระดับเฟร์มี

ในระหว่างช่องว่างของแถบเต็มไปด้วยอิเล็กตรอน แถบที่มีระดับพลังงานสูงสุดเรียกว่า แถบวาเลนซ์ (valence band, VB) และด้านนอกของแถบอิเล็กตรอนเรียกว่า แถบการนำ (conduction band, CB) ความกว้างของแถบพลังงานระหว่างแถบวาเลนซ์และแถบการนำคือ ช่องว่างของแถบอิเล็กตรอน (band gab) โครงสร้างโดยรวมของพลังงานช่องว่างของแถบ อิเล็กตรอนแสดงดังรูป 2.3 ช่องว่างของแถบอิเล็กตรอนถูกพิจารณาจากผนังที่อิเล็กตรอนถูก กระตุ้นเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ ปริมาณของพลังงานที่ใช้ในการกระตุ้นอิเล็กตรอนจากแถบวา เลนซ์ไปยังแถบการนำเรียกว่า พลังงานช่องว่างของแถบอิเล็กตรอน (band gab energy, E<sub>g</sub>) อิเล็กตรอนบางตัวถูกกระตุ้นไปยังผนังและเข้าไปในแถบการนำซึ่งเรียกว่า อิเล็กตรอนแถบการนำ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่อแสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมมีพลังงานมากกว่าหรือ เท่ากับพลังงานช่องว่างของแถบอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนในแถบวาเลนซ์จะถูกกระตุ้นไปยังแถบการ นำพร้อมกันทำให้เกิดหลุม (hole, h<sup>+</sup>) ที่ไม่มีอิเล็กตรอนขึ้นในแถบวาเลนซ์ ตารางที่ 2.2 แสดง ตำแหน่งของแถบการนำ แถบวาเลนซ์ ช่องว่างของแถบอิเล็กตรอนและค่าความยาวคลื่นของ ช่องว่างของแถบอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Carp และคณะ, 2004)



**รูปที่ 2.3** โครงสร้างของพลังงานช่องว่างอิเล็กตรอน (Hoffmann และคณะ, 1995)

# จุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย

สารกึ่งตัวนำ ไฟฟ้า	แถบวาเลนซ์ (อิเล็กตรอนโวลต์)	แถบการนำ (อิเล็กตรอนโวลต์)	ช่องว่างของแถบ อิเล็กตรอน (อิเล็กตรอนโวลต์)	ความยาวคลื่นของ แถบอิเล็กตรอน (นาโนเมตร)
TiO <sub>2</sub>	+3.1	-0.1	3.2	387
SnO <sub>2</sub>	+4.1	+0.3	3.8	326
ZnO	+3.0	-0.2	3.2	387
ZnS	+1.4	-2.3	3.7	335
$WO_3$	+3.0	+0.2	2.8	443
CdS	+2.1	- <mark>0.</mark> 4	2.5	496
CdSe	+1.6	-0.1	1.7	729
GaAs	+1.0	-0.4	1.4	886
GaP	+1.3	-1.0	2.3	539

**ตารางที่ 2.2** ตำแหน่งของแถบอิเล็กตรอนของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าบางชนิด (Robertson, 1996)

### 2.4 ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide, TiO<sub>2</sub>)

### 2.4.1 คำจำกัดความ (Carp และคณะ, 2004)

ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารประกอบกึ่งตัวนำไฟฟ้าที่อยู่ในรูปออกไซด์ของโลหะทรานซิ ชันมีสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเซิงแสง (photocatalyst) โดยสามารถใช้แสงเพื่อกระตุ้นให้อนุภาค ไทเทเนียมไดออกไซด์เกิดปฏิกิริยาแตกตัวเป็นประจุได้และสามารถนำมาใช้ในกระบวนการกำจัด สารอินทรีย์และอนินทรีย์ทั้งในน้ำและอากาศ ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่มี ประสิทธิภาพดีเนื่องจากมีสมบัติโปร่งแสงทำให้แสงผ่านได้ดี มีพื้นที่ผิวสูงซึ่งมีความสัมพันธ์กับการ ดูดซับ ราคาถูก มีความคงตัวไม่เปลี่ยนรูปและไม่ถูกทำลายเมื่อเกิดปฏิกิริยา อีกทั้งไม่เป็นพิษกับ สิ่งแวดล้อม และมีความสามารถในการละลายต่ำทำให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้

### 2.4.2 โครงสร้างผลึกและสมบัติ

โดยทั่วไปไทเทเนียมไดออกไซด์มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ ได้แก่ อนาเทล (anatase) มีโครงสร้างแบบเตตระโกนอล (tetragonal) บรูคไคท์ (brookite) มีโครงสร้างแบบออ โทรอมบิก (orthorhombic) รูไทล์ (rutile) มีโครงสร้างแบบเตตระโกนอล และ TiO<sub>2</sub> (B) มีโครงสร้าง แบบมอนอไซคลิก โครงสร้างแบบอนาเทส รูไทล์ และบรูคไคท์สามารถอธิบายในรูปแบบของออก ตะฮีดรอล (octahedral form, TiO<sub>2</sub><sup>6-</sup>) (Carp และคณะ, 2004) โดยโครงสร้างผลึกทั้ง 3 ชนิดนี้มี ความแตกต่างกันเนื่องจากการบิดตัวของแต่ละออกตะฮีดรอลที่เรียงต่อกันและรูปแบบการเรียงตัว ของออกตะฮีดรอล โดยโครงสร้างผลึกอนาเทสเกิดจากการเรียงตัวต่อกันโดยใช้ส่วนยอดของแต่ละ ออกตะฮีดรอล (รูปที่ 2.2n) ในขณะที่โครงสร้างผลึกรูไทล์เกิดจากการเรียงตัวต่อกันโดยใช้ส่วน ขอบของแต่ละออกตะฮีดรอล (รูปที่ 2.2ข) และโครงสร้างผลึกบรูคไคท์เกิดจากการเรียงตัวต่อกัน โดยใช้ทั้งส่วนยอดและส่วนขอบของแต่ละออกตะฮีดรอล (รูปที่ 2.2ค) (Fujishima และคณะ, 1999) ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างอนาเทสมีความว่องไวและความเสถียรมากกว่า โครงสร้างรูไทล์และบรูคไคท์อาจเนื่องจากความแตกต่างของโครงสร้างแถบพลังงานมีพื้นที่ผิวใน การเกิดปฏิกีริยาเริงแสงมากกว่า (Cheng และคณะ, 1995)



**รูปที่ 2.4** โครงสร้างผลึกของ (ก) อนาเทส (ข) รูไทล์ และ (ค) บรูคไทล์ (Carp และคณะ, 2000)

พื้นฐานการคำนวณทางเทอร์โมไดนามิกส์จากข้อมูลทางความร้อน (ตารางที่ 2.3) พบว่ารู ไทล์เป็นสัณฐานที่มีความเสถียรมากสำหรับทุกอุณหภูมิและความดันที่มากกว่า 60 กิโลบาร์ พลังงานเสรีของกิบบ์แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ขนาดอนุภาคมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับ ความเสถียรของสัณฐาน โดยถ้าขนาดอนุภาคเล็กลงจะมีค่าพลังงานบนพื้นผิวลดลง นอกจากนี้ พลังงานเสรีกิบส์และความดันบนพื้นผิวขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาค ถ้าขนาดอนุภาคทั้ง 3 สัณฐาน เท่ากัน พบว่าอนาเทสมีเสถียรภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่มากสุดเมื่อมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 11 นาโนเมตร ขณะที่บรูคไคท์มีเสถียรภาพมากที่สุดเมื่อมีขนาดอนุภาคระหว่าง 11 ถึง 35 นาโนเมตร และรูไทล์มีความเสถียรภาพมากที่สุดเมื่อขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 35 นาโนเมตร (Carp และคณะ, 2004)

ไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกนำมาใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานรูปอื่น เช่น พลังงานไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) และเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีในกระบวนการเร่ง ปฏิกิริยาเชิงแสง เป็นต้น เนื่องจากไทเทเนียมไดออกไซด์มีค่าดรรชนีการหักเหสูง จึงถูกนำมาใช้ เป็นสารเคลือบป้องกันการสะท้อนของแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน (silicon solar cell) และในอุปกรณ์ทางด้านการมองเห็นชนิดฟิล์มบาง (thin film optical device) หลายชนิด

สมบัติ	รูไทล์	อนาเทส
รูปแบบผลึก	เตตระโ <mark>กน</mark> อล	เตตระโกนอล
พลังงานของแถบอิเล็กตรอน (อิเล็กตรอนโวลต์)	3.030	3.200
ความแข็ง (โมฮ์, Mohs)	6.0-7.0	5.5-6.0
ความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	4.250	3.894
พลังงานอิสระกิบส์ (กิโลแคลอรี่ต่อโมล)	-212.6	-211.4
ค่าคงที่แลตทิซ, a(อังสตรอม)	4.593	3.784
ค่าคงที่แลตทิซ, c(อังสตรอม)	2.959	9.515
จุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส)	1858	เปลี่ยนไปเป็นรูไทล์ที่
		อุณหภูมิสูงประมาณ
		800 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 2.3 สมบัติของรูไทล์และอ<mark>นาเทส (Fujishima</mark> และคณะ, 1999)

ไทเทเนียมไดออกไซด์ยังถูกนำมาใช้เป็นตัวตรวจสอบแก๊ส (gas sensor) เนื่องจากมีค่าการนำ ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปได้ตามองค์ประกอบของแก๊สที่ภาวะบรรยากาศ เช่น สามารถใช้ตรวจสอบ แก๊สออกซิเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ และมีเทน เป็นต้น นอกจากนี้ไทเทเนียมไดออกไซด์ยังสามารถ เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ จึงถูกนำมาใช้เป็นวัสดุทางชีวภาพ เช่น กระดูกเทียม เป็นต้น และพบว่า ไทเทเนียมไดออกไซด์มีประสิทธิภาพสูงทั้งในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมและแบบไม่ ใช้แสงร่วมได้ดีอีกด้วย โดยสามารถใช้เป็นทั้งตัวเพิ่มความสามารถในการทำปฏิกิริยา (promoter) และตัวรองรับ (support) ซึ่งกระบวนการที่ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา is่น การ กำจัดสารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน (NO<sub>x</sub>) การกำจัดสารประกอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย (เช่น ไดออกซิน สารประกอบคลอรีน) การผลิตไฮโดรเจนด้วยปฏิกิริยา Gas shift กระบวนการ สังเคราะห์สาร Fischer-Tropsch การกำจัดสารประกอบซัลเฟอร์ (H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>) เป็นต้น (Fujishima และคณะ, 1999)

้ถึงแม้ว่าโครงสร้า<mark>งผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์มีอยู่หล</mark>ายชนิดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ ้โครงสร้างอนาเทสและรูไทล์<mark>เป็นโครงสร้างผลึกที่</mark>พบเป็นส่ว<mark>นให</mark>ญ่ โดยปกติแล้วโครงสร้างผลึกของ ้อนาเทสสามารถเปลี่ยนเป็นโครงสร้างผลึกแบบรูไทล์ได้ที่อุณหภูมิมากกว่า 600 องศาเซลเซียส นับจนถึงปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากอนาเทสเป็นรูไทล์เป็นอย่าง มาก เนื่องจากโครงสร้างผลึกของ<mark>ไทเทเนียมไดออกไซ</mark>ด์เป็นตัวแปรที่สำคัญมากตัวแปรหนึ่งที่จะ ้กำหนดประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบปกติ (ไม่ใช้ แสงร่วม) หรือเซรามิกที่ใช้ทำเยื่อแผ่นบาง (membrane) นอกจากอุณหภูมิแล้ว ยังมีอีกหลาย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกดังกล่าว ได้แก่ ความดัน ปริมาณของผลึก ความ ไม่สมบูรณ์ของผลึก และขนาดของผลึก การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในกระบวนการเร่ง ปฏิกิริยาเชิงแสง โครงสร้างผลึกทั้งอนาเทสและรูไทล์จึงเป็นที่นิยมนำมาศึกษากันอย่างกว้างขวาง สำหรับปฏิกิริยาเชิงแสงโดยปกตินั้น โครงสร้างผลึกแบบอนาเทสให้ประสิทธิภาพในการเร่ง ปฏิกิริยาสูง คือ มีความว่องไวและเสถียรมากกว่าโครงสร้างผลึกแบบอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจาก โครงสร้างอนาเทสมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากกว่า อย่างไรก็ตามในบางปฏิกิริยาพบว่าโครงสร้างผลึกแบบ ฐไทล์หรือโครงสร้างผลึกผสมระหว่างอนาเทสและรูไทล์ (เช่น อนาเทส 70-75% และรูไทล์ 30-25%) ถูกรายงานว่าให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูงกว่าโครงสร้างผลึกแบบอนาเทสเพียง ้อย่างเดียว นอกจากนี้มีตัวแปรหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาของ แต่ละโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ ได้แก่ พื้นที่ผิว การกระจายตัวของรูพรุน ขนาดของ ้อนุภาคผลึก และที่สำคัญมาก คือ วิธีการสังเคราะห์ผลึกไทเทเนียมไดออกไซด์ (Fujishima และ คณะ, 1999) ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีชื่อทางการค้า Degussa P-25 ประกอบด้วยโครงสร้างแบบอนาเทสและรูไทล์ในอัตราส่วน 80/20 ทำให้มีความว่องไวมากกว่า โครงสร้างแบบเดียว การเพิ่มความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถทำได้โดยการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการแยกอิเล็กตรอนกับหลุมของตัวเร่งปฏิกิริยา

### 2.4.3 ลักษณะของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าและความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง

ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าชนิดเอ็น (n-type semiconductor) ซึ่งนิยม ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงกันมาก สารกึ่งตัวนำแตกต่างจากโลหะ คือ มีความไม่ต่อเนื่องของระดับ พลังงาน ทำให้เกิดเป็นช่องว่างของระดับพลังงาน ส่งผลให้เกิดการแยกจากกันของอิเล็กตรอนและ หลุมหลังจากที่ถูกกระตุ้นด้วยแสง ทำให้ทั้งอิเล็กตรอนและหลุมมีระยะเวลาเพียงพอในการ เคลื่อนที่ผ่านไปยังพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาและก่อให้เกิดปฏิกิริยาในที่สุด ความสามารถของสาร กึ่งตัวนำที่จะถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปยังสารตั้งต้นในการเกิดปฏิกิริยาที่ถูกดูดซับไว้นั้นขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งของค่าแถบพลังงาน (energy band gab) ของสารกึ่งตัวนำและตำแหน่งของศักย์ พลังงานในการเกิดรีดอกซ์ (redox) ของสารที่ถูกดูดซับ (Fujishima และคณะ, 1999) ช่องว่างของ ระดับพลังงานของไทเทเนียมไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 3.0 อิเล็กตรอนโวลต์ ถูกกระตุ้นได้ด้วยแสง ที่มีความยาวคลื่นใกล้แสงอัลตราไวโอเล็ต (ประมาณ 380 นาโนเมตร) (Reutergardh และ langphasuk, 1997)

ตัวเร่งปฏิกิริยาเซิงแสงของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าสามารถดูดซับสารที่ทำปฏิกิริยา 2 ตัว พร้อมกันซึ่งสามารถจ่ายอิเล็กตรอนและรับอิเล็กตรอนจากการกระตุ้นโฟตอนผ่านการดูดซับ (h**v** ≥ E<sub>g</sub>) แถบช่องว่างของสารกึ่งตัวนำและพลังงานศักย์ย้อนกลับแสดงดังรูปที่ 2.5 สารกึ่งตัวนำ ไฟฟ้าสามารถเหนี่ยวนำแสงทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนตัวไปดูดซับบนผิวของอนุภาคซึ่งถูกควบคุม จากตำแหน่งพลังงานช่องว่างของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าและพลังงานศักย์ย้อนกลับของตัวดูดซับ ระดับพลังงานด้านล่างของแถบการนำเกิดปฏิกิริยารีดักชันของอิเล็กตรอนเชิงแสง (photoelectrons) ระดับพลังงานด้านบนของแถบวาเลนซ์หาได้จากความสามารถในการออกซิไดซ์ ของหลุมในแต่ละด้านสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของระบบในการสนับสนุนปฏิกิริยารีดักชัน และออกซิเดชัน (Rajeshwar, 1995)



**รูปที่ 2.5** แถบของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าด้วยพลังงานศักย์ย้อนกลับ (redox potentials) (Carp และ คณะ, 2004)

### 2.5 กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (Photocatalytic process)

### 2.5.1 ข้อมูลทั่วไป

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีออกซิเดชันสมัยใหม่ (Advanced Oxidation Technologies, AOTs) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำที่ ประกอบด้วยสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และสารชีวภาพให้เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์ เนื่องจาก กระบวนการนี้สามารถออกซิไดซ์สารอินทรีย์ที่มีความเป็นพิษสูงและไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วย กระบวนการทางชีวภาพให้กลายเป็นสารประกอบที่มีความเป็นพิษเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี ผลิตผล ที่ได้จากกระบวนการนี้ส่วนใหญ่ คือ คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ (Litter, 1999)

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเร่งปฏิกิริยาในการดูดซับ สารก่อมลพิษบนพื้นผิวและการดูดซับแสงโดยใช้ช่วงแสงที่เหมาะสม (Hermann, 1999) สารกึ่ง ตัวนำไฟฟ้าที่ถูกนำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบอาศัยแสงนั้นควรจะอยู่ในรูปออกไซด์หรือซัลไฟด์ ของโลหะ เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO<sub>2</sub>) แคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) และซิงค์ออกไซด์ (ZnO) โดยสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าแคดเมียมซัลไฟด์หรือซิงค์ออกไซด์ไม่นิยมนำมาใช้ เนื่องมาจากความเป็น พิษของสารเหล่านี้ โดยพบว่าเมื่อฉายแสงให้แก่สารละลายที่มีซิงค์ออกไซด์ปนอยู่ ซิงค์ออกไซด์จะ ถูกกัดกร่อนด้วยแสงทำให้เกิดซิงค์ไอออน (Zn<sup>2+</sup>) ที่มีสมบัติเป็นพิษขึ้น และพบว่าแคดเมียมซัลไฟด์ นั้นมีปัญหาทางด้านความเป็นพิษ เนื่องจากแคดเมียมซัลไฟด์สามารถถูกกัดกร่อนได้ด้วยแสงและ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่มีความว่องไวน้อยกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ (Hermann, 1999) ส่วน ไทเทเนียมไดออกไซด์มีความเสถียรภาพสูงและไม่ละลายในสารละลายเหมือนกับซิงค์ออกไซด์ และแคดเมียมซัลไฟด์ ส่วนข้อดีอื่น ๆ ของไทเทเนียมไดออกไซด์ ได้แก่ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความ ว่องไวสูง ไม่เป็นพิษ และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีราคาไม่แพง ยิ่งไปกว่านั้นไทเทเนียมไดออกไซด์ยัง มีความต้านทานการกัดกร่อนและไม่สูญเสียความว่องไวไปเมื่อถูกนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง (Barbeni และคณะ, 1985)

### 2.5.2 หลักการขอ<mark>งกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง</mark>

คำว่า "photocatalytic" มาจาก photo และ catalyst ดังนั้นกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเซิง แสงจึงหมายถึงกระบวนการที่แสงและตัวเร่งปฏิกิริยาถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยน สภาพทางเคมี (chemical transformations) กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเป็นกระบวนการที่ สามารถออกซิไดซ์สารอินทรีย์ที่มีความเป็นพิษสูงและไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการ ทางชีวภาพให้กลายเป็นสารประกอบที่มีพิษเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี ความแตกต่างระหว่างการเร่ง ปฏิกิริยาแบบปกติ (ไม่ใช้แสงร่วม) และการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง คือ วิธีการที่ใช้ในการกระดุ้น ตัวเร่งปฏิกิริยาโดยการกระตุ้นด้วยความร้อนจะถูกแทนที่โดยการกระตุ้นด้วยความเข้มแสง (Herrmann, 1999) โดยที่การให้พลังงานแสงที่มีพลังงานของแถบการนำกับแถบวาเลนซ์สำหรับ แสงที่ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงมักเป็นแสงอัลตราไวโอเล็ตเนื่องจากพลังงานแสงที่ ให้แก่ระบบมีค่ามากกว่าค่าพลังงานของแถบช่องว่างทำให้เกิดเป็นการกระตุ้นการเกิดอิเล็กตรอน (e) ในแถบการนำและหลุม (h<sup>+</sup>) ในแถบเวเลนซ์ (รูปที่ 2.6) โดยหลุมมีสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์ (oxidizing agent) และอิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agent) ทำให้เกิดอนุมูลอิสระ ของไฮดรอกซิล (Yu และคณะ, 2000)





หลังจากที่สารละลายที่มีสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าได้รับพลังงานโฟตอน (h**v**) ที่มีความยาวคลื่น ที่เหมาะสมเกิดเป็นอิเล็กตรอนกับหลุมแสดงดังสมการ 2.1 อิเล็กตรอนและหลุมที่เกิดจากการ กระตุ้นด้วยแสงสามารถรวมตัวกันอีกได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงหนึ่งส่วนล้านของหนึ่งวินาที ทำ ให้เกิดความร้อนขึ้นแสดงดังสมการ 2.2 หรือคู่อิเล็กตรอนและหลุมอาจจับอยู่ที่ผิวของสารกึ่งตัวนำ ซึ่งคู่อิเล็กตรอนและหลุมสามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่น ๆ ที่ดูดซับหรืออยู่ใกล้ผิวของตัวเร่ง ปฏิกิริยาได้ เช่น ถ้าสารที่มีสมบัติเป็นตัวให้อิเล็กตรอน (electron donor; D) ถูกดูดซับอยู่บนผิว ของตัวเร่งปฏิกิริยา สารนี้จะทำปฏิกิริยากับหลุมและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันขึ้นแสดงดังสมการ 2.3 ในทางตรงข้ามถ้าสารที่มีสมบัติเป็นตัวรับอิเล็กตรอน (electron acceptor; A) ถูกดูดซับอยู่บน ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา สารนี้จะทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนและเกิดปฏิกิริยารีดักซันขึ้นแสดงดัง สมการ 2.4 (Robertson, 1996)

Photoexcitation	Sc + hV	$\rightarrow$	$e^{-} + h^{+}$	(2.1)
Recombination	h <sup>+</sup> + e <sup>-</sup>	$\rightarrow$	heat	(2.2)
Oxidation	$h^+ + D$	$\rightarrow$	$D^+$	(2.3)
Reduction	e + A	$\rightarrow$	A	(2.4)

สำหรับกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงมีกลไกทางเคมีที่เป็นไปได้ 2 กลไก คือ 1) การ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยตรงกับหลุม และ 2) การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยประจุไฮดรอกซิล (OH) (lisz และ Dombi, 1999) โดยประจุไฮดรอกซิลหรือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ที่ผิวเปรียบเสมือน กับดักของหลุมก่อให้เกิดอนุมูลอิสระของไฮดรอกซิลซึ่งเป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรง ซึ่งโดยปกติการ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยประจุไฮดรอกซิลมีแนวโน้มเป็นกลไกหลักในกระบวนการเร่งปฏิกิริยา เซิงแสง ส่วนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยตรงกับหลุมนั้น หลุมจะทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของ สารอินทรีย์ที่ผิวของสารกึ่งตัวน<mark>ำ อนุมูลอิสระของไฮ</mark>ดรอกซิลเหล่านี้สามารถทำปฏิกิริยากับ ้สารประกอบอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีความจำเพาะเจาะจง การยับยั้งการรวมตัวของคู่ ้อิเล็กตรอนและหลุมมีความจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายเทประจุของสารกึ่งตัวนำ ้กับสารละลายอิเล็กโตรไลต์ เนื่องจากการรวมตัวของคู่อิเล็กตรอนและหลุมจะเป็นการขัดขวางการ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Chiou และคณะ, 2007) การเติมออกซิเจนให้แก่ระบบจึงเปรียบเสมือน เป็นกับดักสำหรับอิเล็กต<mark>รอนนำไปสู่การเกิดเป็นซุปเปอร์ออกไซด์</mark> (O<sub>2</sub>) ซึ่งไม่เสถียร สารจำพวก อนุมูลอิสระที่มีความว่องไว (OH<sup>-</sup>, O<sub>2</sub><sup>-</sup>) จะจับกับโมเลกุลของฟีนอลในน้ำแล้วเกิดปฏิกิริยาไฮดรอก ซิเลชันและออกซิเดชัน จ<mark>นได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นคาร์บอน</mark>ไดออกไซด์ น้ำ และสารประกอบ ้อินทรีย์อื่น ๆ โดยสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบซัลเฟอร์และหมู่ฮาโลเจนจะถูกออกซิไดซ์ได้ ผลิตภัณฑ์ คือ ฟอสเฟต (PO₄³) ซัล<mark>เฟต (SO₄²-) และเฮไ</mark>ลด์ (X<sup>-</sup>) ตามลำดับ (Litter, 1999)

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแลงของตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์แสดงดังสมการ 2.5-2.16 (Litter, 1999) โดยตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกกระตุ้นด้วยแสงแตกตัวเป็น อิเล็กตรอนในแถบนำกับหลุมในแถบวาเลนซ์สามารถรวมตัวกันอีกได้อย่างรวดเร็วแสดงดังสมการ 2.5 หลุมในแถบวาเลนซ์ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ำเกิดเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแสดงดัง สมการ 2.6 หลุมในแถบวาเลนซ์ทำปฏิกิริยากับโมะจุไฮดรอกซิลเกิดเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล แสดงดังสมการ 2.7 หลุมทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่มีสมบัติเป็นตัวให้อิเล็กตรอนถูก ดูดซับบนผิวตัวเร่งปฏิกิริยาแสดงดังสมการ 2.8 อนุมูลอิสระของไฮดรอกซิลทำปฏิกิริยากับ สารอินทรีย์แสดงดังสมการ 2.9 อิเล็กตรอนในแถบการนำทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ที่มีสมบัติรับ อิเล็กตรอนถูกดูดซับอยู่บนผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาแสดงดังสมการ 2.10 อิเล็กตรอนในแถบการนำ ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็นเปอร์อนุมูลไฮดรอกซิลสามารถเป็นไปเป็นซุปเปอร์ออกไซด์ซึ่งไม่ เสถียรแสดงดังสมการ 2.11 เปอร์อนุมูลไฮดรอกซิลทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนในแถบการนำเกิด เป็นโมเลกุลของน้ำแสดงดังสมการ 2.12 เปอร์อนุมูลไฮดรอกซิลเกิดเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับ ออกซิเจนแสดงดังสมการ 2.13 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำปฏิกิริยากับซุปเปอร์ออกไซด์เกิดเป็น อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 2.14 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถูกกระตุ้นด้วยแสงเกิดเป็น อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 2.15 ไฮโดรเจนเปอร์ออกซ์ทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนใน แถบการนำเกิดเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 2.16

$$\operatorname{TiO}_2 \xrightarrow{hv} \operatorname{TiO}_2(e_{cb}, h_{vb}) \xrightarrow{} \operatorname{recombination} (2.5)$$

 $TiO_2$  +  $HO_{ada}$  +  $H^+$ 

$$TiO_{2}(h_{vb}^{+}) + HO_{ads}^{-} \longrightarrow TiO_{2} + HO_{ads}$$
(2.7)

 $TiO_2(h_{ub}^+)$  +

H<sub>2</sub>O 1

$$TiO_2 (h_{vb}^+) + D_{ads} \longrightarrow TiO_2 + D_{ads}^+$$
 (2.8)

HO + 
$$D_{ads}$$
  $\longrightarrow$   $D_{oxid}$  (2.9)

$$\operatorname{TiO}_2(\mathbf{e}_{cb}) + \mathbf{A}_{ads} \longrightarrow \operatorname{TiO}_2 + \mathbf{A}_{ads}$$
 (2.10)

$$\operatorname{TiO}_{2}(e_{cb}^{-}) + O_{2 ads} + H^{+} \longrightarrow \operatorname{TiO}_{2} + HO_{2} \longleftrightarrow O_{2}^{-} + H^{+} (2.11)$$

$$\overset{\cdot}{\operatorname{HO}_{2}} + \operatorname{TiO}_{2}(e_{cb}^{-}) + H^{+} \longrightarrow H_{2}O \qquad (2.12)$$

$$2HO_2 \longrightarrow H_2O_2 + O_2$$
 (2.13)

$$H_2O_2 + O_2^- \longrightarrow HO^+ + O_2 + HO^-$$
 (2.14)

$$H_2O_2 + hv \longrightarrow 2HO$$
 (2.15)

$$H_2O_2 + T_iO_2(e_{cb}) \longrightarrow HO' + HO'$$
 (2.16)

อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเซิงแสงส่วนใหญ่เป็นไปตามแบบจำลองของแลงเมียร์-ฮินเซลวูดด์ (Langmuir-Hinshelwood model) (Chiou และคณะ, 2007) ในการอธิบายถึง ลักษณะของปฏิกิริยาเกี่ยวกับอัตราเร็วในการสลายสารอินทรีย์ในรูปของการหายไปของ สารอินทรีย์หรือการเกิดขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ฟลักซ์ของแสงมีความสำคัญมากในการ เกิดปฏิกิริยาเชิงแสง เนื่องจากการให้แสงแก่ระบบมากเกินพอจะทำให้เกิดการรวมตัวของคู่ อิเล็กตรอนและหลุมขึ้นอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิที่สูงมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเชิงแสงที่สูงขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงทำให้ความถี่ในการชนกันระหว่างสารอินทรีย์และสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า และ

(2.6)

พบว่าไอออนของโลหะหรือสารอนินทรีย์ที่อยู่สารละลายนั้นมีความสำคัญต่อการเกิดปฏิกิริยาเชิง แสง (Litter, 1999)

การกำจัดสารอินทรีย์ที่เป็นพิษซึ่งปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอากาศด้วยปฏิกิริยาเชิงแสงเป็น วิธีการที่มีประโยชน์มากในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้เงิน ลงทุนต่ำ และใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานได้ แต่ปัจจุบันยังมีการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา และลดระยะเวลาในการ กำจัดสารอินทรีย์ อย่างไรก็ตามการกำจัดสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาเชิงแสงนั้นจะต้องระมัดระวัง ใน การควบคุมการเกิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่อาจเป็นอันตรายมากกว่าอันตรายจากสารอินทรีย์ตั้งต้น ถ้าปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ (Litter, 1999)

ปฏิกิริยาเชิงแสงสามารถใช้ขจัดสารอินทรีย์หรือจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำและ อากาศได้หลายชนิด เช่น สารประกอบคลอรีนของแอลเคนและแอลคีน ฟีนอล อะโรแมติก แอลดี ไฮด์ กรดอินทรีย์ และเอมีน เป็นต้น (Robertson, 1996) ซึ่งสารประกอบที่สามารถขจัดด้วย ปฏิกิริยาเชิงแสงโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแสดงดังตารางที่ 2.4

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### **ตารางที่ 2**.4 สารประกอบที่สามารถขจัดด้วยปฏิกิริยาเชิงแสงโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา (Robertson, 1996)

ชนิดของสารประกอบ	ตัวอย่าง
Alkanes	methane; pentane; heptane; n-dodecane; cyclohexane;
	paraffin
Haloalkanes	mono-, di-, tri-, and tetrachloromethane; dichloroethane;
	pentachloroethane; di and tribromoethane; I:2-
	dichloropropane
Aliphatic alcohols	methanol; ethanol; n- and iso-propanol; butanol;
	penta-1:4-diol
Aliphatic carboxylic acids	methanoic; ethanoic; trichloroacetic; butyric; oxalic
Alkenes	propene; cyclohexene
Haloalkenes	di-, tri- and tetra-chloroethene; hexafluoropropene
Aromatics	benzene; naphthalene
Haloaromatics	chloro and bromobenzene; chlorobenzenes; halophenols
Phenols	phenol; hydroquinone; catecol; resorcinol; cresol; nitrophenol
Aromatic carboxylic acids	benzoic; phthalic; salicyclic
Polymers	polyethylene; PVC
Surfactants	polyethylene glycol; p-nonyl phenyl ether; sodium dodecyl;
	benzene sulphonate; paraxon; malathion
Herbicides	methyl viologen; atrazine; simazine; bentazon
Pesticides	DDT; parathion; lindane; monocrotophos
Dyes	methylene blue; rhodamine B; methyl orange; fluorescein
Explosives	trinitrotoluene
Bacteria	E. Coli
#### 2.5.3 กลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงของฟีนอล

ปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ในการขจัดพีนอลโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ ร่วมกับแสงอัลตราไวโอเล็ตแสดงดังรูปที่ 2.7 ไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกกระตุ้นด้วยแสงแตกตัวเป็น อิเล็กตรอนกับหลุม เมื่อออกซิเจนจับตัวกับอิเล็กตรอนเกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิลและโมเลกุลของ น้ำจับตัวกับหลุมเกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิล อนุมูลไฮดรอกซิลจับตัวเป็นพีนอลเกิดเป็นไฮโดรควิโนน (hydroquinone) เรซอซินอล (resorcinol) แคทโฮล (catehol) นอกจากนี้รูปแบบของเบนโชควิโนน (benzoquinone) ได้จาก 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1) การดึงอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลของไฮโดรควิโนน 2) การทำปฏิกิริยาในหลุมของไทเทเนียมไดออกไซด์ 3) เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยตรงของไฮโดรควิ โนนจากออกซิเจนในน้ำ หลังจากนั้นแคทโฮลทำปฏิกิริยากับไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับแสงอัล ตราไวโอเล็ตเกิดเป็นไกลคอล (glycol) เรซอซินอลทำปฏิกิริยากับไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับแสงอัล ตราไวโอเล็ตเกิดเป็นไกลคอล (glycol) เรซอซินอลทำปฏิกิริยากับไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับ แสงอัลตราไวโอเล็ตเกิดเป็นกรดบิวทาโนอิก (butanoic acid anhydride) ไฮโดรควิโนนทำ ปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับแสงอัลตราไวโอเล็ตเกิดเป็นกลีเซอริน (glycerin) และอีเทน ไดออล (ethanedial) เปนโซควิโนนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างรวดเร็วประมาณ 40% เกิดเป็น สารประกอบอะลิฟาติกที่ประกอบด้วยออกซิเจนและภายใต้สภาวะเดียวกันจะเปลี่ยนไปเป็นไฮโดร ควิโนนประมาณ 60% นอกจากนี้สารตัวกลางที่ได้จากการทำปฏิกิริยาจะได้กรดฟอร์มิกและกรดอะซิ ติก สุดท้ายของปฏิกิริยาจะได้คระได้คริบอนไดออกไซด์และน้ำ (Sobczyn'ski และคณะ, 2004)



**รูปที่ 2.7** กลไกการเกิดออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของฟืนอล (Sobczyn´ski และคณะ, 2004)

แสงเป็นรูปแบบของคลื่นพลังงานซึ่งแสงแต่ละชนิดสามารถจำแนกออกได้ด้วยความยาว คลื่นที่แตกต่างกันดังรูปที่ 2.8 แสงขาวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแถบความยาวคลื่นแสงทั้งหมดซึ่งมี ความยาวคลื่นในช่วง 400-700 นาโนเมตร แต่โดยปกติแล้วแสงขาวไม่ถูกนำมาใช้สำหรับ กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเนื่องจากทั่วไปแล้วตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในกระบวนการนี้ คือ ใทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งมีพลังงานของช่องว่างแถบพลังงานประมาณ 3.0 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งจะ ตกอยู่ในช่วงของแสงอัลตราไวโอเลต ดังนั้นแสงในช่วงอัลตราไวโอเลตจึงถูกนำมาใช้สำหรับ กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (Fujishima และคณะ, 1999) ชนิดของแสงอัลตราไวโอเล็ตแบ่ง ออกตามความยาวคลื่นดังนี้

- UV-A มีความยาวคลื่น 315-380 นาโนเมตร เป็นรังสี UV ที่สามารถนำมาใช้เป็น ประโยชน์ได้หลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านเคมีและฟิสิกส์
- UV-B มีความยาวคลื่น 280-315 นาโนเมตร เป็นรังสี UV ที่มีประโยชน์ในการ รักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ แต่หากสัมผัสนานเกินไปอาจก่อให้เกิดการไหม้ของ ผิวหนัง (sunburn or erythema)และการอักเสบของตาดำได้
- UV-C มีความยาวคลื่น 100-280 นาโนเมตร เป็นรังสี UV ที่มีประโยชน์ในการฆ่า เชื้อโรคได้ แต่อาจทำอันตรายผิวหนังและตาได้อย่างรุนแรงหากได้รับรังสีเป็น ปริมาณที่มากเกินไป



รูปที่ 2.8 สเปกตรัมของแสง (Fujishima และคณะ, 1999)

#### 2.7 พอลิเมทิลเมทาคริเลต (Polymethylmethacrylate)

พอลิเมทิลเมทาคริเลตหรืออะคริลิกเป็นพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นแบบอะแทกติก (atactic) ดังรูปที่ 2.9 โดยโมเลกุลมีกิ่งหรือแขนงที่ไม่แน่นอน พอลิเมทิลเมทาคริเลตสามารถเตรียม โดยกระบวนการแบบบัลค์ แบบสารละลาย แบบแขวนลอย หรือแบบอิมัลขันก็ได้ขึ้นอยู่กับการ นำไปใช้งาน ตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ใช้ในการสังเคราะห์ คือ เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ พอลิเมอไรเซชัน เกิดแบบลูกโซ่ของอนุมูลอิสระ ถ้าใช้เทคนิคแบบแขวนลอย ตัวแขวนลอยนิยมใช้ คือ โซเดียมพอ ลิอะคริเลต โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 95 - 110 องศาเซลเซียส จะได้พอลิเมอร์ออกมาในขั้นสุดท้าย เป็นเม็ดเล็ก ๆ พอลิเมทิลเมทาคริเลตมีความเหนียวกว่าพอลิสไตรีน มีความโปร่งใสมาก (ยอมให้แสง ผ่านได้ถึง 92%) มีน้ำหนักเบา และมีความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีและทนต่อสารอนินทรีย์ ต่าง ๆ ได้ดี รวมทั้งกรดและด่างเจือจาง จึงนิยมนำมาทำเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา เลนซ์ โคมไฟ ถาดและถ้วยบรรจุของเหลวชนิดใส อุตสาหกรรมที่ใช้พอลิเมทิลเมทาคริเลตมากที่สุด คือ รถยนต์ เครื่องบิน และเรือ โดยใช้ทำไฟข้างหน้า ไฟข้างท้าย ไฟเลี้ยว พวงมาลัย ตลอดจนสาร เคลือบผิวเป็นต้น (ปรีชา พหลเทพ, 2549)



**รูปที่ 2.9** สูตรโครงสร้างของพอลิเมทิลเมทาคริเลต (polymethacrylate)

#### 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Addamo และคณะ (2008) ศึกษาการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์จาก ไทเทเนียมเตตระไอโซโพรพรอกไซด์ (titanium tetraisopropoxide) บนตัวรองรับแก้วที่ผ่านการ เตรียมผิวด้วยซิลิกอนออกไซด์ด้วยเทคนิคการจุ่มเคลือบแล้วนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 673 เคลวิน เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มีความมีขั้วสูงและโครงสร้างผลึก ส่วนใหญ่อยู่ในรูปอนาเทส เมื่อนำไปทดสอบความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงมีประสิทธิภาพ ในการสลายไอโซโพรพานอลภายในเวลา 7 ชั่วโมง กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างสมบูรณ์ และเกิดโพรพาโนน (propanone) เป็นสารตัวกลางที่สามารถตรวจวัดได้ นอกจากนี้ความว่องไว ของตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับการเตรียมผิวก่อนทำการเคลือบและสามารถนำตัวเร่งปฏิกิริยากลับมา ใช้ใหม่ได้

Barakat และคณะ (2005) ศึกษาผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการ ออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายฟีนอลและคลอโรฟีนอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ไทเทเนียมไดออกไซด์ พบว่าการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และแสงอัลตราไวโอเล็ตช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยระบบที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ร่วมกับไทเทเนียม ไดออกไซด์ และแสงอัลตราไวโอเล็ตมีประสิทธิภาพในการสลายฟีนอลมากว่าระบบที่ใช้ไทเทเนียม ไดออกไซด์ และแสงอัลตราไวโอเล็ตมีประสิทธิภาพในการสลายฟีนอลมากว่าระบบที่ใช้ไทเทเนียม ไดออกไซด์ร่วมกับแสงอัลตราไวโอเล็ตหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมกับแสงอัลตราไวโอเล็ต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ช่วยเพิ่มอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ตทำให้อัตราการ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในการสลายฟีนอลและคลอโรฟีนอลเพิ่มขึ้น สารอินทรีย์ถูกดูดซับภายใต้ แสงอัลตราไวโอเล็ตและอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เมื่อเพิ่มความเข้มข้น ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีประสิทธิภาพในการสลายฟีนอลสูงสุดถึง 97%

Hu และ Yuan (2006) ศึกษาการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนพอลิเมอร์ ได้แก่ พอลิเมทิลเมทาคริเลต พอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยซิลิกอนออกไซด์ ยางซิลิโคนเคลือบ ด้วยซิลิกอนออกไซด์ที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้เทคนิคการจุ่มเคลือบ (dip-coating process) จากโซล ไทเทเนียมไดออกไซด์สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส พบว่า โซลไทเทเนียมไดออกไซด์มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 5 นาโนเมตร ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บน ตัวรองรับพอลิเมอร์มีความเป็นรูพรุนและขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 35~47 นาโนเมตร อนุภาค ไทเทเนียมไดออกไซด์เกิดการรวมตัวกันระหว่างกระบวนการเคลือบบนตัวรองรับพอลิเมอร์โดยปรับปรุง การเคลือบผิวด้วยซิลิกอนออกไซด์ก่อนทำการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อช่วยเพิ่ม ความมีขั้วของฟิล์มบางบนตัวรองรับ ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริ เลต พอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยซิลิกอนออกไซด์ ยางซิลิโคนเคลือบบนซิลิกอนออกไซด์ มี ประสิทธิภาพในการสลาย Brilliant red dye X-3B โดยความเข้มข้นของ Brilliant red dye X-3B ลดลงเหลือ 0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายในเวลา 105 นาที 0.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายในเวลา 60 นาที 1.30 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายในเวลา 120 นาที ตามลำดับ นอกจากนี้ฟิล์มบางไทเทเนียมได ออกไซด์มีข้อดี เช่น เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว ราคาถูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทำงานได้ที่ อุณหภูมิต่ำ

Jain และ Shrivastava (2008) ศึกษากระบวนการออกซิเดชันเชิงแร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ของสีย้อมไซยาโนซีน (cyanosine dye) โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์แขวนลอยอยู่ภายใต้ภาวะ ต่าง ๆ โดยปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา ความเข้มข้นของสารตั้งต้น ค่าความ เป็นกรด-เบส และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และตัวรับอิเล็กตรอน พบว่าอัตราการสลายสีย้อมไซยา โนซีนเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา โดยปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมเท่ากับ 0.04 กรัม/ลิตร ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและค่าความเป็นกรด-เบสมีผลต่อการสลายสีย้อม เช่นกัน โดยค่าความเป็นกรด-เบสที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 8 นอกจากนี้ระบบที่ใช้ไทเทเนียมได ออกไซด์ ร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และแสงอัลตราไวโอเล็ตมีประสิทธิภาพในการสลายสี ย้อมสูงสุดถึง 82.45%

Kazuya และคณะ (2003) ศึกษาการเตรียมฟิล์มบางผสมไทเทเนียมไดออกไซด์และพอลิ ไดเมทิลไซลอกเซน (polydimethylsiloxane) บนพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่อุณหภูมิต่ำโดยวิธีโซล-เจลด้วยเทคนิคการปั่น (spin-coating) ซึ่งฟิล์มบางมีความโปร่งแสงสูงขึ้นถึง 90% และโครงสร้าง ผลึกอยู่ในรูปอนาเทส เมื่ออบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าฟิล์มบาง ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์และพอลิไดเมทิลไซลอกเซนให้ประสิทธิภาพในการสลายเมทิลลีนบลู (methylene blue) และอะเซทัลดีไฮด์ (acetaldehyde) มากกว่า 90% นอกจากนี้เมื่อเพิ่มปริมาณ พอลิไดเมทิลไซลอกเซนทำให้ประสิทธิภาพในการสลายเมทิลีนบลูลดลงและเกิดการเสื่อมสภาพ ของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตประมาณ 23.7% โดยน้ำหนัก

Qamar และคณะ (2005) ศึกษาการกำจัดอนุพันธ์ของสีย้อม 2 ชนิด ได้แก่ โครโมโทรป 2 บี (chromotrope 2B) และอะมิโดแบล็ค 10 บี (amido black 10B) ด้วยกระบวนการออกซิเดชัน เชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการละลายที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์แขวนลอยอยู่ภายใต้ภาวะต่าง ๆ โดยปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดของไทเทเนียมไดออกไซด์ ความเป็นกรด-เบส ปริมาณตัวเร่ง ปฏิกิริยา ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตั้งต้น ชนิดของตัวรับอิเล็กตรอนที่แตกต่างกัน ได้แก่ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) โพแทสเซียมโบรเมต (KbrO<sub>3</sub>) และแอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต ([NH<sub>4</sub>]<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>]) รวมถึงโมเลกุลของออกซิเจน พบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ ชนิดพี-25 มี ประสิทธิภาพในการกำจัดอนุพันธ์ของสีย้อมทั้ง 2 ชนิดมากกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ชนิด UV-100 และ PC500 เมื่อความเป็นกรด-เบสสูงขึ้นส่งผลให้อัตราการสลายอนุพันธ์สีย้อมทั้ง 2 ชนิดเพิ่มขึ้น และสูงสุดที่ค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 9 เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นส่งผลให้อัตราการ สลายอนุพันธ์สีย้อมทั้ง 2 ชนิดลดลง และเมื่อใช้ชนิดของตัวรับอิเล็กตรอนเติมลงไปในสารละลาย พบว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โพแทสเซียมโบรเมต และแอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต ช่วยเพิ่มอนุมูล อิสระไฮดรอกซิลและลดการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับหลุม

Swarnalatha และ Anjaneyalu (2004) ศึกษาการออกซิไดซ์ 2,6 ไดไนโตรฟีนอล (2,6dinitrophenol) โดยกระบว<mark>นการออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแส</mark>งโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ ้ได้แก่ ไททาเนียมไดออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ ชนิดพี-25 (TiO<sub>2</sub>-P25) แคดเมียมซัลไฟด์ และซิงค์ออกไ<mark>ซด์ จากการทดลองบ่ง</mark>ชี้ว่<mark>าสารละลาย</mark>ที่แขวนลอยด้วย TiO<sub>2</sub>-P25 ให้ (CdS) ประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการสลายเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ความยาวคลื่นแสง 254 นาโน เมตร นอกจากนั้นได้ศึกษาผ<mark>ลของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณ</mark>ตัวเร่งปฏิกิริยา ความเข้มข้นเริ่มต้น ของ 2.6 ไดไนโตรฟีนอล ระย<mark>ะเวลาของการฉายแสง ค่าคว</mark>ามเป็นกรด-เบส รวมถึงผลของการให้ ออกซิเจนและในโตรเจนต่อประสิทธิภาพการสลาย 2,6 ใดในโตรฟีนอล ซึ่งพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็น 1 กรัมส่งผลให้ระดับการขจัด 2,6 ไดไนโตรฟีนอลสูงถึง 90% จากนั้นเมื่อเพิ่ม ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นไปเรื่อย ๆ ความสามารถในการขจัดจะลดลง ส่วนที่ความเข้มข้นเริ่มต้น ของ 2,6 ไดไนโตรฟีนอลและค่าความเป็นกรด-เบสสูง ๆ จะส่งผลให้อัตราการกำจัดลดลงเช่นกัน โดยค่าความเป็นกรด-เบสที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 8 และเมื่อให้ระยะเวลาของการฉายแสงนานขึ้น พบว่าความเข้มข้นของ 2.6 ไดไนโตรฟืนอลลดลง โดยที่ระยะเวลาของการฉายแสงมากกว่า 3 ชั่วโมง 2,6 ไดไนโตรฟีนอลจะถูกสลายไปอย่างสมบูรณ์ และภายใต้ภาวะที่เหมาะสมการให้แก๊ส คคกซิเจนแก่สารละลายจะให้คัตราการขจัดเร็วกว่าแก๊สไนโตรเจน

Yang และคณะ (2006) ศึกษาการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนพอลิเมอร์อะ ใครโลไนไตรล์-บิวตะไดอีน-สไตรีน (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) และสไตรีน (polystyrene) โดยเทคนิคการจุ่มเคลือบ มีการเติมแอซีทิลอะซีโตน (acetylacetone) ลงในโซลไทเทเนียมได ออกไซด์เพื่อช่วยลดการรวมกลุ่มกันของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ โปร่งใส กระจายตัวดีขึ้นและ มีความเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส พบว่าเมื่อเพิ่มความหนาของฟิล์ม และอัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมทำให้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มีรอย แตกและรูพรุนเกิดขึ้นบนผิวของฟิล์มเนื่องจากการระเหยและการสลายตัวของสารละลายและแอ ซีทิลอะซีโตน ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มีความต้านทานต่อตัวทำละลายและความมีขั้วสูง ระหว่างผิวของฟิล์มบางกับตัวรองรับ เมื่อนำไปทดสอบความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยา ฟิล์มบาง ไทเทเนียมไดออกไซด์มีประสิทธิภาพในการสลายเมทิลลีนบลูภายในเวลา 180 นาที

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนำเทคนิคการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงมาใช้เป็นวิธีการบำบัดหรือขจัด สารประกอบฟีนอลออกจากน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหาการสะสมหรือเกิดการอุดตันภายในเครื่องมือและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ในการแยกอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ออกภายหลังการใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝัง ไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการลดปริมาณฟีนอลในน้ำ เสียจำลอง

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 3

## วิธีดำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบน พอลิเมทิลเมทาคริเลตด้วยวิธีการจุ่มเคลือบ และศึกษาลักษณะสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียม ได้ รวมทั้งตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิท<mark>ธิภาพใน</mark>การสลายฟีนอลด้วยปฏิกิริยาเชิงแสง

### 3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย

- 1. เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส ยี่ห้อ HACH รุ่น sension 378
- เครื่องชั่งละเอียด
- เครื่องกวนแม่เหล็ก
- 4. ตู้อบ (Oven)
- 5. เตาเผา (Furnace)
- 6. โถดูดความชื้น (desicator)
- 7. นาฬิกาจับเวลา
- 8. หลอดไฟ UV กำลังไฟฟ้า 9 วัตต์ Philip รุ่น PL-S
- เครื่องการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffractometer: XRD) JEOL รุ่น JSM-5800
   LV
- 10. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM) Jeol รุ่น JSM 6400
- 11. เครื่อง UV-VIS spectrophotometer Jasco รุ่น V-530
- 12. เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ

## 3.2 สารเคมีที่ใช้

- 1. ไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดทางการค้า Degussa P-25 (ประเทศสิงคโปร์)
- 2. แอซีทิลอะซีโตน (LR Grade, S D Fine-Chem Limited) (ประเทศอินเดีย)
- 3. ไอโซโพรพานอล (AR Grade, Lab supplies) (ประเทศนิวซีแลนซ์)
- 4. กรดในตริก (AR Grade, QRec, Qatar) (ประเทศนิวซีแลนด์) และมีความบริสุทธิ์ 65%

5. ฟีนอล (Analytical reagent Grade, Fisher Scientific) (ประเทศนิวซีแลนด์) และมี ความบริสุทธิ์ 99.5%

#### 3.3 วิธีการดำเนินงานวิจัย

### 3.3.1 การเตรียมน้ำเสียตัวอย่าง

น้ำเสียตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้ เป็นน้ำเสียสังเคราะห์ที่ได้จากการเตรียมสารละลายฟีนอล ที่ความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม แ<mark>ล้วนำไปทำก</mark>ารทดลอง

#### 3.3.2 การเตรียมผิวแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต

ก่อนทำการเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ นำแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตมาล้างผิวด้วย สารละลายกรดในตริกเจือจาง โดยเตรียมสารละลายกรดในตริกผสมน้ำในอัตราส่วนกรดในตริก 6 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน จุ่มแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตลงในสารละลายกรดในตริกเจือจางเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นล้างออกด้วยเอทานอลและน้ำกลั่น ทำให้แห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 2 ชั่วโมง

## 3.3.3 การเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์

ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกนำมาเคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตโดยวิธีการ จุ่มเคลือบ (dip-coating) แสดงดังรูป 3.1ก แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต (20×130×2 มิลลิเมตร) ที่ ผ่านการเตรียมผิวแล้วถูกนำมาเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ สารละลายไทเทเนียมได ออกไซด์เตรียมได้โดยการเติมสารละลายไอโซโพรพานอลผสมน้ำในอัตราส่วนไอโซโพรพานอล 7 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วน ลงในไทเทเนียมไดออกไซด์ทั้งที่ผ่านการเผา (calcination) และไม่ผ่านการเผา ทำการกวนเป็นเวลา 15 นาที แล้วจึงเติมแอซีทิลอะซีโตนลงไปในสารละลายด้วยอัตราส่วนโดย โมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์ในช่วง 1.0-4.0 ทำการกวนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนได้สารละลายที่เป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นนำแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตจุ่มลงในสารละลาย ไทเทเนียมไดออกไซด์ ทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที ทำให้แห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะได้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริเลตจากนั้น



**รูปที่ 3.1** ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต (ก) แผ่นพอลิเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ และ (ข) การวางแผ่นพอลิ เมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ในเครื่องปฏิกรณ์

ตรวจสอบลักษณะพื้นผิวของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตภายหลังเคลือบด้วยฟิล์มบางไทเทเนียม ใดออกไซด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา ไทเทเนียมไดออกไซด์ สามารถวัดสัณฐานของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิการเผาต่าง ๆ ได้ จากเครื่องการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ จากนั้นนำไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ ต่าง ๆ มาเคลือบแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตตามวิธีที่กล่าวไว้เบื้องต้น จากนั้นวางแผ่นพอลิ เมทิลเมทาคริเลตที่ผ่านการเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ในที่วางแผ่นให้มีลักษณะคล้ายกับครีบ (baffle) ในเครื่องปฏิกรณ์ (รูปที่ 3.1ข)

#### 3.3.4 การทดลองออกซิเดชันเชิงแสงของฟีนอลเร่งปฏิกิริยาด้วยไทเทเนียมได ออกไซด์ที่เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต

เครื่องปฏิกรณ์สำหรับการทดลองออกซิเดชันเชิงแสงของฟีนอลเร่งปฏิกิริยาด้วยไทเทเนียม ใดออกไซด์เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตดังแสดงในรูปที่ 3.2 ประกอบด้วยถังออกซิเจน กล่องฉายรังสีอัลตราไวโอเล็ตซึ่งควบคุมการไหลของแก๊สออกซิเจนที่ 200 มิลลิลิตรต่อนาที และ อุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส ถูกควบคุมโดยใช้การไหลของน้ำเข้า-ออก ภายในกล่องมีเครื่องปฏิกรณ์ทำจากแก้วปริมาตร 1 ลิตรล้อมรอบด้วยหลอดอัลตราไวโอเล็ต ขนาด 9 วัตต์ จำนวน 15 หลอด ในการทดลองนำแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบไทเทเนียมได ออกไซด์วางรอบตะแกรงวงกลมคล้ายกับครีบในเครื่องปฏิกรณ์แล้วนำไปแซ่ในสารละลายฟีนอล ในน้ำปราศจากไอออนที่ความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 50 ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) เก็บสารละลาย ครั้งละ 10 มิลลิลิตร ทุกชั่วโมงเป็นเวลา 5 ชั่วโมง เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลคงเหลืออยู่ ด้วยเครื่อง UV-VIS spectrometer โดยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษามีดังตารางที่ 3.1



**รูปที่ 3.2** เครื่องปฏิกรณ์สำหรับการขจัดฟีนอลด้วยกระบวนการออกซิเดชันเชิงแสงเร่งปฏิกิริยา ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต

## จุฬาลงกรณ่มหาวิทยาลัย

## ตารางที่ 3.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาการขจัดฟีนอลด้วยกระบวนการออกซิเดชันเชิงแสงเร่ง ปฏิกิริยาด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต

ตัวแปร	ช่วงที่ใช้ในการศึกษา
จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์	2-8 แผ่น
ค่าความเป็นกรด-เบส	3-9
ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล	10-100 พีพีเอ็ม
กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล <mark>็ต</mark>	45-135 วัตต์
ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	0-1 โมลาร์
อัตราการไหลของแก๊สออก <mark>ซิเจน</mark>	0-800 มิลลิลิตรต่อนาที
อุณหภูมิในการทำปฏิกิริย <mark>า</mark>	30-70 องศาเซลเซียส

## 3.3.5 ทดสอบลักษณะสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์

3.3.5.1 เครื่องการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffractometer: XRD)

เครื่องการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ที่ใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้เป็น รุ่น D8 Discover ของ Bruker เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของสารตัวอย่างถูกบันทึกด้วยเครื่อง Rugaku RINT 2000 diffractometer โดยใช้ตัวกรองนิกเกิล แหล่งกำเนิดแสง CuKα (ความยาวคลื่น เท่ากับ 1.542 อังสตรอม) ที่ 40 กิโลโวลต์และ 30 มิลลิโวลต์ สารตัวอย่างถูกดันเข้าไปอยู่ ในหลอดแก้วแล้วพักไว้ที่กระจกแก้ว หลังจากนั้นจะวัดที่ 20 เท่ากับ 15 ถึง 70 องศา โดย ใช้วิธีการแบบต่อเนื่องในอัตรา 5 องศาต่อนาที ผลการวิเคราะห์แสดงพีกซึ่งบ่งบอกชนิดของ สารประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง รวมทั้ง 20 ค่า d และค่าเข้มแสง และสามารถนำมาใช้ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างผลึกของสารตัวอย่างนั้น ๆ ได้ โดยไทเทเนียมได ออกไซด์มีความเป็นผลึก 2 สัณฐานด้วยกัน คือ สัณฐานอนาเทสแสดงพีกที่ 101 (20 ~ 25.3 องศา) และสัณฐานรูไทล์ที่ 110 (20 ~ 27.35 องศา)

# 3.3.5.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่ใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้เป็น รุ่น JSM-5800 LV ยี่ห้อ JEOL กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นเครื่องมือที่ใช้ วิเคราะห์ลักษณะสัณฐาน (morphology) ตัวอย่างจะถูกเคลือบด้วยทองเพื่อให้เกิดการนำ ไฟฟ้าก่อนนำไปวัดที่อัตราการเร่งศักย์ไฟฟ้าที่ 15 กิโลโวลต์

3.3.5.3 เครื่อง UV-VIS spectrophotometer

เครื่อง UV-VIS spectrophotometer ที่ใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยนี้เป็น รุ่น V-530 ยี่ห้อ Jasco ใช้ในระบุความสามารถในการดูดกลืนแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาเซิงแสง โดย การวิเคราะห์ในช่วงความยาวคลื่น 190-800 นาโนเมตร และใช้ในการวัดปริมาณของฟีนอล โดยใช้หมวดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อหาปริมาณฟีนอลคงเหลือ โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้

- นำสารตัวอย่างวิเคราะห์ในช่วงความยาวคลื่น 190-800 นาโนเมตร เพื่อ หาความยาวคลื่นสูงสุด (λ<sub>max</sub>) ของฟีนอล จะได้ความยาวคลื่นสูงสุด เท่ากับ 269 นาโนเมตร ดังแสดงในภาคผนวก ก
- ทำ Calibration curve โดยวัดที่ค่าความยาวคลื่นเท่ากับ 269 นาโนเมตร จะได้สมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้น ของฟีนอล แสดงในภาคผนวก ข

 นำสารตัวอย่างไปทำการวัดที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 269 นาโนเมตร จะ ได้ค่าการดูดกลืนแสง

 คำนวณหาปริมาณฟีนอลคงเหลือจากสมการความสัมพันธ์ แสดงตัวอย่าง การคำนวณในภาคผนวก ข

## 3.4 การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การออกแบบการทดลองแฟกทอเรียลสองระดับ (Montgomery, 2001)

การออกแบบเซิงแฟกทอเรียลใช้กันมากในการทดลองที่เกี่ยวกับหลายปัจจัย โดยศึกษาถึง ผลของปัจจัยหลักและปัจจัยร่วมต่อการตอบสนองซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านั้น การออกแบบแฟก ทอเรียลสองระดับ (2<sup>k</sup>) มีประโยชน์มากในการคัดเลือกปัจจัยสำคัญและความสัมพันธ์ของปัจจัย เหล่านั้น การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลสองระดับเช่นนี้จะทำให้เกิดการทดลองจำนวนน้อยที่สุดที่ สามารถจะทำได้เพื่อศึกษาถึงผลของปัจจัยทั้ง k ชนิดได้อย่างบริบูรณ์ ในงานวิจัยนี้ทำการศึกษา 4 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดฟืนอล ระดับของปัจจัยแต่ละตัวจะแทนด้วยระดับ "ต่ำ (-1)" และ "สูง (+1)" ช่วงในการศึกษาปัจจัยแสดงดังตารางที่ 3.2 แบบจำลองการคำนวณการ ออกแบบ 2<sup>4</sup> ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก 6 อันตรกิริยาของสองปัจจัย 4 อันตรกิริยาของสามปัจจัย และ 1 อันตรกิริยาของสี่ปัจจัย ดังนั้นแบบจำลองการออกแบบเชิงแฟกทอเรียล 2<sup>4</sup> ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 2<sup>4</sup> – 1 โดยทั่วไปการคำนวณการออกแบบ 2<sup>4</sup> หาได้จาก 5 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนประมาณผลของปัจจัยต่าง ๆ และคำนวณผลรวมของกำลังสอง ของแต่ละปัจจัย โดยคอนแทรสต์ (contrast) ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละปัจจัยในการคำนวณขั้นแรกนั้น สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายบวกและลบ ดังแสดงในตารางภาคผนวก ค

ตารางที่ 3.2	สภาวะของการออกแบบ 2 <sup>4</sup> ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในก	ารขจัดฟีนอลด้วยการเร่ง
	ปฏิกิริยาเซิงแสง	

ปัจจัย	ชื่อ	ระดับต่ำ (-1)	ระดับสูง (+1)
А	จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบ TiO <sub>2</sub>	2 แผ่น	8 แผ่น
В	ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล	50 พีพีเอ็ม	100 พีพีเอ็ม
С	กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต	45 วัตต์	135 วัตต์
D	ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	0 โมลาร์	0.626 โมลาร์

้โดยทั่วไปคอนแทรสต์ของปัจจัย "ABCD" หาได้จากการอธิบายทางด้านขวามือของสมการ 3.1

คอนแทรสต์<sub>ABCD</sub> = 
$$(a\pm 1)(b\pm 1)(c\pm 1)(d\pm 1)$$
 (3.1)

คอนแทรสต์ที่ใช้ในการประมาณผลและผลรวมของกำลังสอง คำนวณตามสมการ 3.2 และสมการ 3.3 ตามลำดับ โดย n คือจำนวนครั้งในการทำซ้ำ

การประมาณผล<sub>ABCD</sub> = 
$$\frac{2}{n2^4}$$
 (ABUMNSสต์<sub>ABCD</sub>) (3.2)  
ผลรวมของกำลังสอง<sub>ABCD</sub> =  $\frac{2}{(PDUMNSAG(ABCD)^2)}$  (3.3)

 $n2^4$ 

ขั้นตอนที่สองเป็นการทดลอง 16 <mark>ครั้งได้จากออกแบบเ</mark>ชิงแฟกทอเรียล 2<sup>4</sup> ประกอบด้วย ปัจจัยหลักและอันตรกิริยา

ขั้นตอนที่สามเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) เพื่อประมาณค่าปัจจัยหลักและอันตรกิริยาที่สำคัญ ตารางที่ 3.3 แสดงรูปแบบทั่วไปของ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับการออกแบบเชิงแฟคทอเรียล 2<sup>4</sup> ด้วยการทำซ้ำจำนวน n ครั้ง และใช้ F<sub>0</sub> ในการประมาณค่าถ้าตัวแปรนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญ

ขั้นตอนที่สี่เป็นการปรับแต่งการออกแบบโดยการกำจัดปัจจัยที่ไม่สำคัญ เมื่อได้ปัจจัย สำคัญแล้วจะประมาณค่าสัมประสิทธิ์คำนวณตามสมการ 3.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของการ ทดลองหาได้จากรากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ดังสมการ 3.5 ค่าความคลาดเคลื่อน มาตรฐาน (standard error, se) สำหรับการประมาณค่าปัจจัยและประมาณค่าสัมประสิทธิ์ คำนวณตามสมการ 3.6 และ 3.7 ตามลำดับ

แบบจ้าลอง	ผลรวม	ร้อยละการกระจายตัว	ตัวแปร	ค่าเฉลียกำลังสอง	F <sub>0</sub>
	กำลังสอง		อิสระ		
ปัจจัยหลัก					
A	SS <sub>A</sub>	$= (SS_A/SS_T) \times 100$	1	$MS_A = SS_A/1$	$= MS_A / M$
В	SS <sub>B</sub>	= (SS <sub>B</sub> /SS <sub>T</sub> )×100	1	$MS_B = SS_B/1$	= MS <sub>B</sub> / I
С	$SS_{c}$	$= (SS_C/SS_T) \times 100$	1	$MS_c = SS_c/1$	= MS <sub>C</sub> / I
D	SSD	$= (SS_D/SS_T) \times 100$	1	$MS_{D} = SS_{D}/1$	= MS <sub>D</sub> /I
อันตรกิริยาของ					
สองปัจจัย					
AB	SS <sub>AB</sub>	$= (SS_{AB}/SS_{T}) \times 100$	1	$MS_{AB} = SS_{AB}/1$	$= MS_{AB}/$
AC	SS <sub>AC</sub>	$= (SS_{AC}/SS_{T}) \times 100$	1	$MS_{AC} = SS_{AC}/1$	$= MS_{AC}/$
AD	SS <sub>AD</sub>	$= (SS_{AD}/SS_{T}) \times 100$	1	$MS_{AD} = SS_{AD}/1$	$= MS_{AD}/$
BC	SS <sub>BC</sub>	$= (SS_{BC}/SS_{T}) \times 100$	1	$MS_{BC} = SS_{BC}/1$	$= MS_{BC}/$
BD	$SS_{BD}$	$= (SS_{BD}/SS_{T}) \times 100$	1	$MS_{BD} = SS_{BD}/1$	$= MS_{BD}/$
CD	$SS_{CD}$	$= (SS_{CD}/SS_{T}) \times 100$	1	$MS_{CD} = SS_{CD}/1$	$= MS_{CD}/$
อันตรกิริยาของ		13 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	The second		
สามปัจจัย					
ABC	SS <sub>ABC</sub>	$= (SS_{ABC}/SS_{T}) \times 100$	1	$MS_{ABC} = SS_{ABC}/1$	$= MS_{ABC}$
ABD	SS <sub>ABD</sub>	$= (SS_{ABD}/SS_{T}) \times 100$	1	$MS_{ABD} = SS_{ABD}/1$	$= MS_{ABD}$
ACD	SS <sub>ACD</sub>	$= (SS_{ACD}/SS_{T}) \times 100$	1	$MS_{ACD} = SS_{ACD}/1$	$= MS_{ACD}$
BCD	SS <sub>BCD</sub>	$= (SS_{BCD}/SS_{T}) \times 100$	9.10	$MS_{BCD} = SS_{BCD}/1$	$= MS_{BCD}$
อันตรกิริยาของ	9	5 6 11 5 11 6	112	1110	
สี่ปัจจัย					
ABCD	SS <sub>ABCD</sub>	$= (SS_{ABCD}/SS_{T}) \times 100$	1	$MS_{ABCD} = SS_{ABCD}/1$	=MS <sub>ABCE</sub>
ค่าความคลาด	$SS_{E}$	$= (SS_{E}/SS_{T}) \times 100$	2 <sup>4</sup> (n-1)	$MS_{E} = SS_{E}/2^{4}(n-1)$	
เคลื่อน					
ผลรวม	SST		n2 <sup>4</sup> -1		
เมือ	SS <sub>⊤</sub> คือ ผ	ลรวมกำลังสองของแต่ล	ะปัจจัย		
	SS <sub>E</sub> คือ ผ	เลรวมกำลังสองที่เกิดจา	กความคล	าดเคลื่อน	
	SS <sub>E</sub> = S	$SS_{\tau} - SS_{subtatala}$			
โดย	е с С с		20		

**ตารางที่ 3.3** การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับการออกแบบ 2<sup>4</sup>

$$S = \sqrt{MS_E}$$
(3.5)

se (การประมาณค่าปัจจัย) = 
$$\frac{2S}{\sqrt{n2^4}}$$
 (3.6)

se (การประมาณค่าสัมประสิทธิ์) =  $\frac{S}{\sqrt{n2^2}}$  (3.7)

เมื่อ S คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

MS<sub>e</sub> คือ ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง

se คือ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่าปัจจัยเป็นสองเท่าของค่าความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในการจำลองการถดถอยของการออกแบบ 2⁴ ขั้นตอนที่ ห้าเป็นการวิเคราะห์ส่วนตกค้างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

## 3.4.1 ผลตกค้าง (Residuals) และการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model adequacy checking) (Montgomery, 2001)

ก่อนสรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความถูกต้องของแบบจำลองต้องทำการ ตรวจสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบเบื้องต้น คือ การวิเคราะห์ผลตกค้าง (residual analysis) ผลตกค้าง (residuals, e) ของการออกแบบเชิงแฟกทอเรียลสี่ปัจจัย แสดงดังสมการ 3.8

$$e = Y \cdot \dot{Y}$$
(3.8)

เมื่อ Y คือ ค่าจริง $\hat{\mathbf{Y}}$  คือ ค่าทำนาย

การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองทำได้ง่ายโดยการวิเคราะห์ผลตกค้างด้วย กราฟความสัมพันธ์ดังนี้ 3.4.1.1 ความสัมพันธ์ของ Normal probability กับผลตกค้าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง Normal probability และผลตกค้างเป็นขั้นตอนที่เป็นประโยชน์ อย่างมากเพราะในการวิเคราะห์ความแปรปรวนมักมีผลกับผลตกค้าง ถ้าการกระจายตัวของความ คลาดเคลื่อนเป็นปกติ จะได้ชุดข้อมูลเป็นเส้นตรง เส้นตรงที่ปรากฏจะให้ความสำคัญกับค่ากลาง มากกว่าค่าสูงสุด

3.4.1.2 ความสัมพันธ์ของผลตกค้างกับค่าทำนาย

ถ้าแบบจำลองถูกต้อง ส่วนตกค้างไม่ควรมีความสัมพันธ์เป็นโครงสร้าง (Structureless) ซึ่งในส่วนสำคัญควรไม่สัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ๆ รวมทั้งค่าตอบสนองที่ทำนายได้ การตรวจสอบ อย่างง่ายโดยการสร้างกราฟระหว่างส่วนตกค้าง (e) เปรียบเทียบกับค่าทำนาย Y โดยกราฟนี้จะ ไม่แสดงให้เห็นรูปแบบหรือโครงสร้างที่ชัดเจน

3.4.2 สมการถดถอย (Montgomery, 2001)

ในการออกแบบเชิงแฟกทอเรียลสองระดับเป็นการออกแบบที่ง่ายให้ผลที่ชัดเจนในการ ทดลองในเทอมของสมการถดถอย (regression model) เพราะการออกแบบเชิงแฟกทอเรียลสอง ระดับเป็นเพียงการออกแบบเชิงแฟกทอเรียลของแต่ละปัจจัยหรือสามารถใช้แบบจำลองค่าเฉลี่ย แต่สมการถดถอยมีความเป็นธรรมชาติมากและใช้งานง่ายสำหรับการทำนายค่าใด ๆ สมการ ถดถอยแสดงดังสมการ 3.9

$$\stackrel{\wedge}{\mathbf{Y}} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k \qquad (i = 1, 2, \dots, m) \qquad (3.9)$$

เมื่อ

^ Y \_ คือ ค่าทำนายใด ๆ ( i คือ จำนวนของค่าตอบสนองของตัวแปร)

- X₅ คือ สัญลักษณ์แทนปัจจัยใด ๆ ( k คือ จำนวนปัจจัยหลัก)
- β ดีอ ค่าตอบสนองเฉลี่ยของการออกแบบเชิงแฟกทอเรียล (จุดตัดแกน y)
- β<sub>κ</sub> คือ ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ (สัมประสิทธิ์ถดถอย)

### บทที่ 4

#### ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

#### 4.1 ผลของอัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์และจำนวน รอบในการเคลือบต่อลักษณะและประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล

รูปที่ 4.1 แสดงภาพพื้นผิวที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของ ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริเลต พบว่าการยึดเกาะของ ไทเทเนียมไดออกไซด์บนพอลิเมทิลเมทาคริเลตขึ้นกับอัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตน (acetyl acetone, ACA) ต่อไทเทเนียมไดออกไซด์ (ACA/TiO<sub>2</sub>) โดยการเพิ่ม ACA/TiO<sub>2</sub> จาก 1.0 (รูปที่ 4.1ก) และ 2.0 (รูปที่ 4.1ข) ไปเป็น 3.0 (รูปที่ 4.1ค) และ 4.0 (รูปที่ 4.1ง) ทำให้ฟิล์มบาง ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้มีความเรียบและเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นเนื่องจากแอซีทิลอะซี โตนช่วยเพิ่มความมีขั้วและการเกาะติดบนผิวของพอลิเมอร์ (Yang และ Han, 2008)



**รูปที่ 4.1** ภาพพื้นผิวที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของฟิล์มบางไทเทเนียมได ออกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่อัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อ ไทเทเนียมไดออกไซด์ (ก) ACA/TiO<sub>2</sub> = 1.0 (ข) ACA/TiO<sub>2</sub> = 2.0 (ค) ACA/TiO<sub>2</sub> = 3.0 และ (ง) ACA/TiO<sub>2</sub> = 4.0 (จำนวนรอบในการเคลือบสารละลายไทเทเนียมได ออกไซด์ = 3 รอบ) รูปที่ 4.2 แสดงผลของจำนวนรอบในการจุ่มเคลือบสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์บน แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตต่อปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต เมื่อ กำหนดให้ ACA/TiO<sub>2</sub> คงที่ที่ 3.0 พบว่าจำนวนรอบในการเคลือบ 1 (รูปที่ 4.2ก) และ 3 รอบ (รูปที่ 4.2ข) ส่งผลให้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้มีความเรียบและเป็นเนื้อเดียวกัน แต่เมื่อ เพิ่มจำนวนรอบในการเคลือบเป็น 5 (รูปที่ 4.2ค) และ 10 รอบ (รูปที่ 4.2ง) ส่งผลให้ฟิล์มบางที่ เตรียมได้มีรอยแตกเกิดขึ้นบนผิวของฟิล์ม ทั้งนี้อาจเกิดจากการระเหยของตัวทำละลายและแอ ซีทิลอะซีโตนซึ่งมีมากกว่าการจุ่มเคลือบ 1 และ 3 รอบ ขณะที่ทำการอบแผ่น (Jang และ Han, 2008)

ตารางที่ 4.1 แสดงอิทธิพลของอัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียม ไดออกไซด์และจำนวนรอบในการจุ่มเคลือบสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อประสิทธิภาพใน การขจัดฟืนอลที่ความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง พบว่าเมื่อกำหนดจำนวนรอบของการเคลือบสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 3 รอบ การเพิ่ม อัตราส่วนของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอล เพิ่มขึ้น อัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 3.0 ให้ประสิทธิภาพใน การขจัดฟืนอล 62.5% ทั้งนี้เนื่องมาจากแอซีทิลอะซีโตนช่วยเพิ่มความมีขั้วของฟิล์ม



**รูปที่ 4.2** ภาพพื้นผิวที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของฟิล์มบางไทเทเนียมได ออกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่จำนวนรอบในการเคลือบ (ก) 1 รอบ (ข) 3 รอบ (ค) 5 รอบ และ (ง) 10 รอบ (ACA/TiO<sub>2</sub> = 3.0)

อัตราส่วนโดยโมล- ของแอซีทิลอะซีโตน ต่อไทเทเนียมได ออกไซด์	จำนวนรอบใน การเคลือบ ไทเทเนียม ไดออกไซ <mark>ด์</mark>	ปริมาณไทเทเนียมได ออกไซด์บนแผ่นพอลิ เมทิลเมทาคริเลต* (กรัม)	การขจัด ฟีนอลที่ 5 ชั่วโมง (%)
1.0	3	0.18	41.6
2.0	3	0.36	43.2
3.0	3	0.57	62.5
4.0	3	0.76	60.0
5.0	3	0.39	49.8
3.0	1 1 1	0.33	59.5
3.0	5	0.64	68.5
3.0	10	0.96	54.4

## **ตารางที่ 4.1** ผลของอัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์และจำนวน รอบในการเคลือบต่อประสิทธิภาพการขจัดฟีนอล

\* ปริมาณรวมไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตจำนวน 8 แผ่น ภาวะที่ใช้ในการทดลอง : ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล = 50 พีพีเอ็ม ค่าความเป็นกรด-เบส = 5.5 กำลังของหลอดยูวี = 135 วัตต์ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส

บางไทเทเนียมไดออกไซด์ไปยังผิวของพอลิเมทิลเมทาคริเลตทำให้ไทเทเนียมไดออกไซด์เกาะติดบน ผิวของพอลิเมทิลเมทาคริเลตมากขึ้น (Hu และ Yuan, 2006) จึงทำให้ประสิทธิภาพในการ ขจัดฟืนอลเพิ่มขึ้น แต่เมื่ออัตราส่วนของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเป็น 5.0 กลับลดประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอล เนื่องจากปริมาณตัวทำละลายแอซีทิลอะซิโตนมีมาก เกินไป

สำหรับผลของจำนวนรอบในการเคลือบสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นพอลิ เมทิลเมทาคริเลตที่ ACA/TiO<sub>2</sub> เท่ากับ 3.0 พบว่าจำนวนรอบในการจุ่มเคลือบมากขึ้นส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับมากขึ้น เมื่อความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้น และพบว่าจำนวนรอบในการจุ่มเคลือบเท่ากับ 5 รอบ มี ประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลได้มากที่สุดถึง 68.5% อย่างไรก็ตามการเพิ่มจำนวนรอบในการจุ่ม เคลือบมากเกินไปส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลลดลง ซึ่งเกิดจากการบดบังแสงกันเอง ของไทเทเนียมไดออกไซด์บนผิวของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต (Fujishima และคณะ,1999, Liu และคณะ, 2006)

เมื่อวิเคราะห์หาปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอยู่จริงบนผิวของพอลิเมทิลเมทาคริเลต ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนซึ่งใช้ Energy-Dispersive X-ray Spectrometer ดังตารางที่ 4.2 พบว่าผิวของพอลิเมทิลเมทาคริเลตมีไทเทเนียมไดออกไซด์อยู่จริง ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ จำนวนรอบในการจุ่มเคลือบสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ 1 3 5 และ 10 รอบเท่ากับ 47.7 54.8 54.0 และ 52.9% โดยน้ำหนัก ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์บนผิว ของพอลิเมทิลเมทาคริเลตเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มจำนวนรอบในการเคลือบจาก 1 รอบ ไปเป็น 3 รอบ แต่ เมื่อเพิ่มจำนวนรอบในการเคลือบเป็น 5 และ 10 รอบ ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์บนผิวของพอ ลิเมทิลเมทาคริเลตลดลง ทั้งนี้อาจเกิดจากความสามารถที่จำกัดในการยิงอิเล็กตรอนลงบนผิวของ พอลิเมทิลเมทาคริเลตในช่วงความหนาค่าหนึ่ง จึงทำให้ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ที่วิเคราะห์ ได้มีปริมาณลดลง

ร้องของเป็นเอออเเอรื่องเ	Т	i
ึ่งเห็งหรือกเห็บเริ่ยผู้ดูก —	wt%	at.%
1	47.7	22.9
3	54.8	28.6
5	54.0	27.8
10	52.9	27.0

**ตารางที่** 4.2 ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอยู่จริงบนผิวของพอลิเมทิลเมทาคริเลต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 4.2 ผลของอุณหภูมิในการเผาไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล

ประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอลของตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ขึ้นอยู่กับสัณฐาน ของไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยรูปที่ 4.3 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction, XRD) ของไทเทเนียมไดออกไซด์ก่อนและหลังผ่านการเผาที่อุณหภูมิในช่วง 400-800 องศาเซลเซียส พบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ก่อนการเผาและหลังการเผาที่อุณหภูมิในช่วง 400-800 องศา เซลเซียส มีโครงสร้างผลึกแบบผสมระหว่างสัณฐานแบบอนาเทสและรูไทล์ในอัตราส่วนที่แตกต่าง กัน พบตำแหน่งพีกอนาเทส 20 ที่ 25.2 37.9 47.8 53.8 และ 55.0 องศา และตำแหน่งพีกรูไทล์ 20 ที่ 27.4 36.1 41.2 และ 54.3 องศา (Smith, 1960) ตารางที่ 4.3 แสดงผลของอุณหภูมิการเผาต่อ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของสัณฐานแบบอนาเทส/รูไทล์และระดับการสลายฟืนอลที่ 5 ชั่วโมง พบว่า ไทเทเนียมไดออกไซด์ Degussa P-25 ประกอบด้วยสัณฐานแบบอนาเทส/รูไทล์เท่ากับ 70/30 โดย น้ำหนัก จากงานวิจัยของ Magglie และคณะ (2001) รายงานว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีสัณฐาน ผสมระหว่างอนาเทส (70-75%) และรูไทล์ (30-25%) มีความว่องไวสูงกว่าการมีสัณฐานเพียง อย่างเดียวซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย เมื่อเผาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงถึง 700 องศา เซลเซียสทำให้สัณฐานแบบอนาเทสเปลี่ยนไปเป็นรูไทล์ (Xie และ Yuan, 2003) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ มีความว่องไวต่ำกว่าแบบอนาเทส (Fujishima และคณะ, 1999) โดยระดับการสลายฟืนอลของ ไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลง 23.4% ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส



**รูปที่ 4.3** ผลของอุณหภูมิในการเผาต่อรูปแบบ XRD ของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์: (ก) ไม่ เผา (ข) 400 องศาเซลเซียส (ค) 500 องศาเซลเซียส (ง) 600 องศาเซลเซียส (จ) 700 องศาเซลเซียส และ (ฉ) 800 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิการเผา	อัตราส่วนโดยน้ำหนักของสัณฐาน	การขจัดฟีนอลที่ 5 ชั่วโมง <sup>*</sup>
(องศาเซลเซียส)	แบบอนาเทส/รูไทล์	(%)
ไม่เผา	70/30	68.5
400	77/22	50.7
500	68/32	62.5
600	67/33	36.2
700	51/49	23.4

**ตารางที่ 4.3** อัตราส่วนโดยน้ำหนักของสัณฐานแบบอนาเทสต่อรูไทล์ที่อุณหภูมิการเผาไทเทเนียม ไดออกไซด์แตกต่างกัน

\* ภาวะที่ใช้ในการทดลอง : จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ = 8 แผ่น ความ เข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล = 50 พีพีเอ็ม ค่าความเป็นกรด-เบส = 5.5 ก<mark>ำ</mark>ลังของหลอดยูวี = 135 วัตต์ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส

### 4.3 จลนพลศาสตร์ของการขจัดฟีนอลด้วยออกซิเดชั้นเชิงแสงเร่งปฏิกิริยาด้วยไทเทเนียม ไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต

ในการศึกษาจลนพลศาสตร์ของการขจัดฟืนอลด้วยออกซิเดชันเชิงแสงเร่งปฏิกิริยาด้วย ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริเลต ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอลที่ใช้ใน การศึกษาเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม ที่ค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายในช่วง 5 ถึง 7 เก็บน้ำ ตัวอย่างออกมาวิเคราะห์ปริมาณฟืนอลคงเหลือทุก 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จากงานวิจัยของ Naeem และ Ouyang (2009) พบว่าสมการจลนพลศาสตร์ของแลงเมียร์-ฮินเซลวูด (Langmuir-Hinshelwood) เป็นสมการที่เหมาะสมในการอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง โดย อัตราการเกิดปฏิกิริยาของการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงแสดงดังสมการ 4.1

$$r = -\frac{dC}{dt} = \frac{k_r K C_s}{(1 + K C_s)}$$
(4.1)

เมื่อ r คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยา (พีพีเอ็มต่อนาที)

C คือ ความเข้มข้นตั้งต้นของฟีนอล (พีพีเอ็ม)

t คือ เวลาของปฏิกิริยา (นาที)

- k, คือ ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยา (นาที<sup>-1</sup>)
- K คือ ค่าคงที่ของการดูดซับของฟีนอล

ในกรณีที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นมีค่าน้อยมาก พจน์ของ KC<sub>s</sub> สามารถตัดทิ้งได้ และ กำหนดให้ k<sub>r</sub>K คือ ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาปรากฏ (k<sub>app</sub>) ของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม (pseudo first order reaction) แสดงดังสมการ 4.2 เมื่อสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ ในการทำปฏิกิริยาและ –In (C<sub>r</sub>/C<sub>0</sub>) ความชันของกราฟที่ได้ คือ ค่า k<sub>app</sub>

$$-\ln\left(\frac{C_{t}}{C_{0}}\right) = k_{app}t$$
(4.2)

- เมื่อ k<sub>app</sub> คือ ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาปรากฏของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม (นาที<sup>-1</sup>)
  - C<sub>0</sub> คือ ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล (พีพีเอ็ม)
  - C, คือ ความเข้มข้นของฟืนอล ณ เวลานั้น (พีพีเอ็ม)

## 4.3.1 ผลของจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์สะท้อนถึงปริมาณ ไทเทเนียมไดออกไซด์ในระบบ โดยในส่วนนี้ศึกษาผลของจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบ ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ต่ออัตราการสลายตัวของฟืนอล ภาวะที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ความ เข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอลเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม อุณหภูมิ 30 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง การเพิ่มปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาทำได้โดยการเพิ่มจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่ผ่านการ เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ รูปที่ 4.4 แสดงค่าคงที่ปฏิกิริยา (k<sub>app</sub>) เมื่อใช้จำนวน แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์แตกต่างกัน พบว่าอัตราการสลายฟืนอล เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มจำนวนแผ่นเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มาก ขึ้นจาก 2 แผ่น (ปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ 0.14 กรัม) เป็น 8 แผ่น (ปริมาณไทเทเนียมได ออกไซด์ 0.57 กรัม) โดยค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อใช้แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบ ด้วยไทเทเทเนียมไดออกไซด์จำนวน 8 แผ่นเท่ากับ 3.1×10<sup>-3</sup> นาที<sup>-1</sup> เนื่องจากการเพิ่มแผ่นพอลิ เมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นการเพิ่มจำนวน active sites ในการ



ร**ูปที่ 4.4** ผลของจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อค่าคงที่ ปรากฏอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงในการขจัดฟีนอล (ความเข้มข้น เริ่มต้นของฟีนอล = 50 พีพีเอ็ม ค่า pH เริ่มต้น = 5.5 กำลังของหลอดยูวี = 135 วัตต์ ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส)

เกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าความหนาแน่นของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อพื้นที่การฉายแสง มากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกำจัดฟืนอลสูงขึ้น (Noorgahan และคณะ, 2003) นอกจากนี้ การเพิ่มจำนวนไทเทเนียมไดออกไซด์ยังเป็นการลดการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนกับหลุมเพื่อทำ ปฏิกิริยาดูดซับตัวรองรับบนพื้นผิวได้เร็วขึ้น (Jung และคณะ, 1999, Lathasree และคณะ, 2004, Jung และคณะ, 2004)

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ เท่ากับ 8 แผ่น มาใช้ในการศึกษาผลของปัจจัยอื่น ๆ ต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสงขจัดฟืนอลต่อไป

#### 4.3.2 ผลของค่าความเป็นกรด-เบสต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายเป็นตัวแปรที่สำคัญในกระบวนการเร่ง ปฏิกิริยาเชิงแสง ไม่เพียงแต่ปรับสมบัติของน้ำเสียแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงประจุของไทเทเนียมได ออกไซด์ ประจุของโมเลกุลฟืนอล การดูดซับฟืนอลไปยังผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์และความ เข้มข้นของอนุมูลไฮดรอกซิล ภาวะที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอลเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยค่าความเป็นกรด-เบสที่ใช้ใน การศึกษาในช่วง 3-9 โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 1 โมลาร์ เป็น สารที่ใช้ในการทำการปรับค่าความเป็นกรด-เบส ค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยา (k<sub>app</sub>) ที่ ความเป็นกรด-เบสต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 4.5 พบว่าเมื่อค่าความเป็นกรด-เบสสูงขึ้นช่วยเพิ่มอัตรา การสลายฟืนอลสูงสุดในช่วงค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 5 ซึ่งมีค่าคงที่ปรากฏของอัตราการ เกิดปฏิกิริยาเท่ากับ 3 × 10<sup>-3</sup> นาที<sup>-1</sup> ที่ความเป็นกรดถึงกลาง เนื่องจากที่ภาวะความเป็นกรด-เบส ในช่วงนี้ฟืนอลเริ่มต้นอยู่ในรูปที่ไม่มีไอออน มีความสามารถในการละลายน้ำน้อยที่สุดจึงถูกดูดชับ

ไปบนตัวเร่งปฏิกิริยาได้มากที่สุด ทำให้อัตราการสลายตัวของฟีนอลเพิ่มขึ้น (Chiou และคณะ, 2008) จากนั้นเมื่อสารละลายมีความเป็นเบสมาก (pH = 9) ทำให้อัตราการสลายตัวของฟีนอลลดลง เนื่องจากพบว่าในภาวะที่สารละลายเป็นเบสสามารถละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อยู่บนผิวของ พอลิเมทิลเมทาคริเลตไฮดรอกไซด์ไอออนจากเบสที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในสารละลายไม่ได้ถูก ออกซิไดซ์ให้กลายเป็นอนุมูลไฮดรอกซิล ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลลดลง (Konstantinou และ Albanis, 2003)

โดยทั่วไปประสิทธิภาพของการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซับ ของสารมลพิษบนผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา และความเข้มข้นของอนุมูลไฮดรอกซิลในระบบ ค่าความ เป็นกรด-เบสไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสมบัติของผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาแต่ยังมีผลต่อการเกิดขึ้นของ อนุมูลไฮดรอกซิล ในกรณีที่ไม่มีการละลายของไทเทเนียมไดออกไซด์ออกมาปนอยู่ในสารละลาย การเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดปฏิกิริยาภายใต้ภาวะเบสนั้นเกิดมาจากการมีไฮดรอกไซด์ไอออนมาก ในสารละลาย ส่งผลให้อนุมูลไฮดรอกซิลมากขึ้น ส่วนภายใต้ภาวะที่สารละลายมีความเป็นกรดนั้น จะเกิดอนุมูลเปอร์ไฮดรอกซิลขึ้น (perhydroxyl radical, HO<sub>2</sub>•) การทำปฏิกิริยาระหว่างอนุมูล ซุปเปอร์ออกไซด์กับโปรตอน สามารถรวมตัวกันได้เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นการเพิ่ม จำนวนอนุมูลไฮดรอกซิลให้แก่ระบบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการสลายตัวองสารประกอบอินทรีย์ เพิ่มขึ้นแสดงดังสมการที่ 4.3-4.13 (Yang และคณะ, 1999) ไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกกระตุ้นด้วย แสงแตกตัวเป็นอิเล็กตรอนในแถบการนำกับหลุมในแถบวาเลนซ์แสดงดังสมการ 4.3 หลุมในแถบ



**รูปที่ 4.5** ผลของค่าความเป็นกรด-เบสต่อค่าคงที่ปรากฏอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในการ ขจัดฟีนอล (ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล = 50 พีพีเอ็ม จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเม ทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ = 8 แผ่น กำลังของหลอดยูวี = 135 วัตต์ ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส)

วาเลนซ์ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ำเกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 4.4 หลุมในแถบ วาเลนซ์ทำปฏิกิริยากับไฮดรอกไซด์ไอออนเกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 4.5 อิเล็กตรอนในแถบการนำทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็นอนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์แสดงดังสมการ 4.6 อนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์ทำปฏิกิริยาโปรตอนเกิดเป็นอนุมูลเปอร์ไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 4.7 อนุมูลเปอร์ไฮดรอกซิลจับตัวกันเองเกิดเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับออกซิเจนแสดงดังสมการ 4.8 อนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์ทำปฏิกิริยากับอนุมูลเปอร์ไฮดรอกซิลเกิดเป็นเปอร์ไฮดรอกไซด์ไอออน แสดงดังสมการ 4.9 เปอร์ไฮดรอกไซด์ไอออนทำปฏิกิริยากับโปรตอนเกิดเป็นไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์แสดงดังสมการ 4.10 อิเล็กตรอนในแถบการนำทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กิด เป็นอนุมูลไฮดรอกซิลแสดงดังสมกา 4.11 อนุมูลซุปเปอร์ออกไซด์ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 4.12 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถูกกระตุ้นด้วยแสง แตกตัวเป็นอนุมูลไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 4.13

$$TiO_2 \xrightarrow{hv} h^{\dagger} + e^{-1}$$
 (4.3)

$$H_2O + h^+ \longrightarrow OH + H^+$$
 (4.4)

$$OH_{(s)} + h^{\dagger} \longrightarrow OH$$
 (4.5)

$$O_2 + e^- \longrightarrow O_2^-$$
 (4.6)

$$O_2 + H^+ \longrightarrow HO_2 \quad pKa = 4.88$$
 (4.7)

$$HO_2 + HO_2 \longrightarrow H_2O_2 + O_2$$
 (4.8)

$$O_2 + HO_2 \longrightarrow HO_2 + O_2$$
 (4.9)

$$HO_2^- + H^+ \longrightarrow H_2O_2$$
(4.10)

$$H_2O_2 + e \longrightarrow HO + OH$$
 (4.11)

$$H_2O_2 + O_2 \longrightarrow OH + OH + O_2$$
 (4.12)

$$H_2O_2 \xrightarrow{hv} 2OH$$
 (4.13)

ค่า pH of zero point charge (pH<sub>zpc</sub>) ของตัวเร่งปฏิกิริยาถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี ความสำคัญที่สามารถบ่งชี้ลักษณะของไทเทเนียมไดออกไซด์ หาได้จากสมการ 4.14

$$pH_{zpc} = 1/2 (pK_{a1}^{s} + pK_{a2}^{s})$$
 (4.14)

สำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ Degussa P-25 มีค่าคงที่ความว่องไวของพื้นผิว pK<sup>°</sup><sub>a1</sub> (ค่าคงที่การแตกตัวของกรดครั้งที่หนึ่ง) เท่ากับ 4.5, pK<sup>°</sup><sub>a2</sub> (ค่าคงที่การแตกตัวของกรดครั้งที่ สอง) เท่ากับ 8 และ pH<sub>zpc</sub> เท่ากับ 6.25 (Komann และคณะ, 1991) ดังนั้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อค่าความเป็นกรด-เบสมากกว่า pH<sub>zpc</sub> จะมีประจุเป็นลบของไทเทเนียมไดออกไซด์ในรูป TiO<sup>-</sup> และ Ti-OH ในขณะที่ TiOH<sub>2</sub><sup>+</sup> จะเกิดขึ้นเมื่อค่าความเป็นกรด-เบสน้อยกว่าค่า pH<sub>zpc</sub> (Doong และคณะ, 2001, Wang และคณะ, 1999) ดังนั้นที่ค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายเท่ากับ 5 ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีประจุเป็นบวก ขณะที่ฟื่นอลแตกตัวแล้วจะมีประจุเป็นลบ สามารถถูก ดูดซับบนผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาได้ดี ประสิทธิภาพการกำจัดฟื่นอลจึงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริเวณใกล้ ผิวของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ มีค่าความหนาแน่นของอนุมูลไฮดรอกซิลมากที่สุดส่งผลให้ ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงเกิดได้ดี (Chiou และคณะ, 2008)

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมได ออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น และค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 5 มาใช้ในการศึกษาผลของปัจจัยอื่น ๆ ต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงขจัดฟีนอลต่อไป

#### 4.3.3 ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอลต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เชิงแสงของฟืนอลแสดงดังรูปที่ 4.6 โดยภาวะที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเม ทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ที่ค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายเท่ากับ 5 โดยความเข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอลที่ศึกษา อยู่ในช่วง 10-100 พีพีเอ็ม พบว่าอัตราการสลายฟืนอลลดลงเมื่อความเข้มข้นของฟืนอลเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการสลายตัวขึ้นอยู่กับอนุมูลไฮดรอกซิลบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาและความเป็นไป ได้ของอนุมูลไฮดรอกซิลในการทำปฏิกิริยากับฟืนอล ดังนั้นเมื่อความเข้มข้นของฟืนอลในสารละลาย มีค่าสูง ทำให้ประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอลของไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลงเพราะฟืนอลจะเข้ามา ดูดชับที่ผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณมาก ทำให้อนุมูลไฮดรอกซิลบนพื้นผิวของไทเทเนียม ไดออกไซด์ลดลงและแสงไม่สามารถเข้าถึงผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งการอิ่มตัวที่ผิวของ ไทเทเนียมไดออกไซด์มีผลทำให้ไทเทเนียมไดออกไซด์เฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยา (Arana และคณะ, 2004)

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมได ออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 5 และความเข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอลเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม มาใช้ในการศึกษาผลของปัจจัยอื่น ๆ ต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสงขจัดฟืนอลต่อไป

![](_page_66_Figure_0.jpeg)

ร**ูปที่ 4.6** ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชันในการขจัดฟีนอล (จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วย ไทเทเนียมไดออกไซด์ = 8 แผ่น ค่า pH เริ่มต้น = 5 กำลังของหลอดยูวี = 135 วัตต์ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส)

#### 4.3.4 ผลของกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

กำลังหลอดอัลตราไวโอเล็ตสะท้อนถึงปริมาณความเข้มแสงอัลตราไวโอเล็ต รูปที่ 4.7 แสดงผลของกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตต่ออัตราการสลายตัวฟีนอลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชัน เชิงแสง ภาวะที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมได ออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ที่ค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายเท่ากับ 5 ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟี นอล 50 พีพีเอ็ม โดยกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตที่ใช้ในศึกษาอยู่ในช่วง 45-135 วัตต์ พบว่า ค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงในการขจัดฟีนอลมีค่าเพิ่มขึ้นตาม กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต โดยกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตที่ 45 99 และ 135 วัตต์ มี ค่าคงที่ปรากฏเท่ากับ 0.9×10<sup>-3</sup> 1.7×10<sup>-3</sup> และ 3×10<sup>-3</sup> นาที<sup>-1</sup> ตามลำดับ เนื่องจากการเพิ่มกำลัง ของหลอดอัลตราไวโอเล็ตช่วยเพิ่มอนุมูลไฮดรอกซิลเหมือนกับการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ลดการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับหลุม จึงทำให้อัตราการสลายฟีนอลเพิ่มขึ้นกำลังของหลอดอัลตรา ไวโอเล็ตมากขึ้น (Chiou และคณะ, 2008)

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมได ออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 5 ความเช้มช้นเริ่มต้นของฟีนอลเท่ากับ 50 พี พีเอ็ม และกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตเท่ากับ 135 วัตต์ มาใช้ในการศึกษาผลของปัจจัยอื่น ๆ ต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริย<mark>าออก</mark>ซิเดชันเชิงแสงขจัดฟีนอลต่อไป

![](_page_67_Figure_2.jpeg)

ร**ูปที่ 4.7** ผลของกำลังของหลอดยูวีต่อค่าคงที่ปรากฏอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง ในการขจัดฟีนอล (จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมได ออกไซด์ = 8 แผ่น ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม ค่า pH เริ่มต้น = 5 ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส)

#### 4.3.5 ผลของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่ออัตราการสลายตัว ของฟีนอล

ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีผลต่อการขจัดฟืนอลด้วยออกซิเดชันเชิงแสง เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวออกซิไดซ์ที่แรงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เติมลงไปใน สารละลายเพื่อช่วยเพิ่มการเกิดอนุมูลไฮดรอกซิลในปฏิกิริยาการแตกตัวด้วยแสง (photoassisted reaction) ภาวะที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียม ใดออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวล<mark>า 5 ชั่วโมง ที่ค่าความเป็นกรด-เบสของ</mark> สารละลายเท่ากับ 5 โดยความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ศึกษาอยู่ในช่วง 0-6.26 โมลาร์ ผลของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าคงที่ปรากฎของอัตราการสลายตัวของฟีนอล ด้วยออกซิเดชันเชิงแสง แสดงดังรูปที่ 4.8 พบว่าค่าคงที่ปรากฏของปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงใน การสลายฟีนอลเพิ่มขึ้นจาก 3×10<sup>-3</sup> ถึง 7.2×10<sup>-3</sup> เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ ้ออกไซด์จาก 0 ถึง 0.62 โมลาร์ เนื่องจากการปรับปรุงความว่องไวของไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วย การเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในช่วงความเข้มข้นถึง 0.62 โมลาร์ ทำให้เกิดการกระจายตัวของ อนุมูลไฮดรอกซิลที่ใช้ในการออกซิไดซ์บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา ส่งผลให้อัตราการสลายฟีนอล เพิ่มขึ้น โดยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์รวมตัวกับอิเล็กตรอนในแถบการนำเกิดเป็นอนุมูลไฮดรอก ซิลแสดงดังสมการ 4.15 ซึ่งเป็นการลดการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับหลุม อนุมูลเปอร์ออกไซด์ ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 4.16 ทำให้ ปริมาณอนุมูลไฮดรอกซิลในระบบสูงขึ้น ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มอัตราการสลายฟืนอลได้มากขึ้น (Reddy และ Kotaiah, 2006, Sauer และคณะ, 2002) อย่างไรก็ตามการใช้ความเข้มข้นของไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์สูงเกินกว่า 0.62 โมลาร์ ทำให้ค่าคงที่ปรากฏมีค่าลดลงแสดงดังสมการ 4.17-4.20 เนื่องจากการอนุมูลไฮดรอกซิลทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เกิดเป็นอนุมูลเปอร์ไฮดรอกซิล แสดงดังสมการ 4.17 อนุมูลไฮดรอกซิลทำปฦิกิริยากับอนุมูลเปอร์ไฮดรอกซิลเกิดเป็นออกซิเจนกับ ้โมเลกุลของน้ำแสดงดังสมการ 4.18 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำปฏิกิริยากับหลุมในแถบวาเลนซ์ เกิดเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์กับออกซิเจนแสดงดังสมการ 4.19 อนุมูลไฮดรอกซิลเกิดการจับตัว กันเองเกิดเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แสดงดังสมการ 4.20 ส่งผลให้อัตราการสลายฟืนอลลดลง (Sun และคณะ, 2007, Edwars และคณะ, 1982)

$$\operatorname{TiO}_{2}(e_{CB}) + H_{2}O_{2} \longrightarrow \operatorname{TiO}_{2} + OH + OH$$
 (4.15)

$$O_2 + H_2O_2 \longrightarrow OH + OH + O_2$$
 (4.16)

$$OH + H_2O_2 \longrightarrow HO_2 + H_2O$$
 (4.17)

$$OH + HO_2 \longrightarrow O_2 + H_2O$$
 (4.18)

$$\operatorname{TiO}_{2}(h^{+}_{VB}) + H_{2}O_{2} \longrightarrow \operatorname{TiO}_{2} + O_{2} + 2H^{+}$$
(4.19)

$$OH + OH \longrightarrow H_2O_2$$
 (4.20)

![](_page_69_Figure_6.jpeg)

**รูปที่ 4.8** ผลของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าคงที่ปรากฏอัตราการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสงในการขจัดฟีนอล (จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วย ไทเทเนียมไดออกไซด์ = 8 แผ่น ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล = 50 พีพีเอ็ม ค่า pH เริ่มต้น = 5 กำลังของหลอดยูวี = 135 วัตต์ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส)

#### 4.3.6 ผลของอัตราการใหลของแก๊สออกซิเจนต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการสลายตัวของฟีนอล ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง แสดงดังรูปที่ 4.9 โดยภาวะที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จำนวนแผ่น พอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ที่ค่าความเป็นกรด-เบสของ สารละลายเท่ากับ 5 ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม โดยออกซิเจนที่ใช้ในศึกษา มีอัตราการไหลอยู่ในช่วง 0-800 มิลลิลิตรต่อนาที พบว่าค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสงในการสลายฟีนอลมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.4×10<sup>-3</sup> ถึง 3.3×10<sup>-3</sup> นาที<sup>-1</sup> เมื่ออัตราการ ไหลของออกซิเจนเพิ่มขึ้นจาก 0 ไปยัง 400 มิลลิลิตรต่อนาที เนื่องจากการป้อนออกซิเจนเข้าไปใน ระบบเป็นการเพิ่มปริมาณโมเลกุลออกซิเจนซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนกับ หลุม โดยสามารถอธิบายได้จากสมการ 4.21 (Ollis และคณะ, 1991, Murov และคณะ, 1993)

$$e^{-}(TiO_2) + O_2 \longrightarrow O_2^{-}$$
 (4.21)

ซึ่งโมเลกุลของออกซิเจนทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนในแถบการนำแล้วเปลี่ยนรูปเป็นอนุมูลซุปเปอร์ ออกไซด์ ซึ่งจะทำปฏิกิริยาต่อไปกับไอออนไฮโดรเจนเกิดเป็นอนุมูลเปอร์ไฮดรอกซิล ผลสุดท้ายจะ เกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิล ทำให้อัตราการสลายฟืนอลเพิ่มขึ้น (Reutergardh และคณะ,1997) นอกจากนี้ไทเทเนียมไดออกไซด์ต้องการออกซิเจนในการกระตุ้นในการเกิดอนุมูลไฮดรอกซิลและ นำไปสู่การจับตัวกับอิเล็กตรอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอลสูงขึ้น (Chun และคณะ, 2000) แต่เมื่ออัตราการไหลของออกซิเจนเท่ากับ 800 มิลลิลิตรต่อนาที อัตราการสลายตัวของฟืนอล มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่มากเกินไปจะไปยับยั้งการทำงานของไทเทเนียมได ออกไซด์ ทำให้อัตราการสลายตัวของฟืนอลลดลง (Wei และ Wan, 1991)

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมได ออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 5 ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลเท่ากับ 50 พี พีเอ็ม กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตเท่ากับ 135 วัตต์ และอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน เท่ากับ 200 มิลลิลิตรต่อนาที มาใช้ในการศึกษาผลของปัจจัยอื่น ๆ ต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตรา การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงขจัดฟีนอลต่อไป

![](_page_71_Figure_0.jpeg)

![](_page_71_Figure_1.jpeg)

#### 4.3.6 ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการสลายตัวของฟืนอลด้วย ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง แสดงดังรูปที่ 4.10 โดยภาวะที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จำนวนแผ่นพอลิ เมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ที่ค่าความเป็นกรด-เบสของ สารละลายเท่ากับ 5 ความเช้มข้นเริ่มต้นของฟืนอลเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม โดยอุณหภูมิที่ใช้ในศึกษา อยู่ในช่วง 30-70 องศาเซลเซียส พบว่าค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิง แสงในการสลายฟืนอลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น เมื่อคำนวณหา ค่าพลังงานกระตุ้นจากสมการของ Arrhenius Equation (สมการ 4.22) แสดงดังรูป 4.11 พบว่าค่า พลังงานกระตุ้นของระบบเท่ากับ 0.01 กิโลจูลต่อโมล แสดงว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เชิงแสงไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยในช่วง (20-80 องศาเซลเซียส) โดยทั่วไป ปฏิกิริยาออกซิเดชันเซิงแสงสามารถเกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิห้องและไม่ต้องให้ความร้อนจากภายนอก (Hermann, 1999) ถึงแม้ว่าปฏิกิริยานี้จะมีค่าพลังงานกระตุ้นต่ำซึ่งมีผลน้อยมากต่อการกระตุ้น


**รูปที่ 4.10** ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสงในการขจัดฟีนอล (จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วย ไทเทเนียมไดออกไซด์ = 8 แผ่น ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม ค่า pH เริ่มต้น = 5 กำลังของหลอดยูวี = 135 วัตต์ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส)



ร**ูปที่ 4.11** ผลการคำนวณค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาตามสมการ Arrhenius Equation

อิเล็กตรอนของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีแถบช่องว่างที่กว้าง แต่พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาเป็น
ตัวควบคุมการเกิดอนุมูลไฮดรอกซิลซึ่งใช้ในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง (Matthew,
1987) ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงอาจเกิดมาจากการเคลื่อนที่
ของอิเล็กตรอนไปยังออกซิเจน (Hoffmann, 1995) หรือในอีกแง่หนึ่ง คือ เกิดจากการคายซับอย่าง
รวดเร็วระหว่างตัวรองรับ (substrate) และตัวกลาง (intermediate) จากไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ดี
ที่อุณหภูมิสูง ทำให้มีพื้นที่ว่างในการทำปฏิกิริยามากขึ้นเป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง
ได้ดีขึ้น (Hermann, 1995)

$$\ln k = -\frac{E_a}{RT} \ln A \tag{4.22}$$

หลังจากที่ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล ได้ภาวะที่เหมาะสมต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง ได้แก่ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 5 ความเข้มข้น เริ่มต้นของฟีนอลเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตเท่ากับ 135 วัตต์ ความเข้มข้น ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เท่ากับ 50 พีพีเอ็ม อัตราการไหลของออกซิเจนเท่ากับ 200 มิลลิลิตร ต่อนาที และอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส ซึ่งจะได้ค่าคงที่ของอัตราการ สลายตัวของฟีนอลเท่ากับ 7.2×10<sup>-3</sup> min<sup>-1</sup> ซึ่งสามารถขจัดฟีนอลได้ 91.4%

# 4.4 การวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ ต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล

ในการศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ต่อระดับการสลายตัวของฟีนอล โดยใช้ ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตจะเลือกตัวแปรที่ มีผลมากต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล โดยอาศัยการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลสอง ระดับและนำตัวแปรมาผูกความสัมพันธ์ในเทอมของสมการถดถอย จากหัวข้อที่ 4.3 ได้แก่ จำนวน แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล กำลัง ของหลอดอัลตราไวโอเล็ต และความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับนำมาใช้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัย ต่าง ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล ปัจจัยหลัก 4 ปัจจัยประกอบด้วยจำนวนแผ่นพอลิ เมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ (A) ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล (B) กำลังของ หลอดอัลตราไวโอเล็ต (C) และความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (D) ผลของการออกแบบ การทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลที่ 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2<sup>4</sup> แสดงดังตารางที่ 4.4

การออกแบบปัจจัย											
การ ทดลอง	จำนวนแผ่นพอลิ เมทิลเมทาคริเลต ที่เคลือบ TiO <sub>2</sub> (แผ่น)	ความเข้มข้น เริ่มต้นของ ฟีนอล (พีพีเอ็ม)	กำลังของ หลอดยูวี (วัตต์)	ความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (โมลาร์)	ประสิทธิภาพ การขจัด ฟีนอล (%)						
1	2	50	45	0	9.71						
2	8	50	45	0	24.15						
3	2	100	45	0	4.21						
4	8	100	45	0	16.2						
5	2	50	135	0	35.85						
6	8	50	135	0	69.03						
7	2	100	135	0	10.2						
8	8	100	135	0	39.38						
9	2	50	45	0.62	14.2						
10	8	50	45	0.62	45.42						
11	2	100	45	0.62	7.86						
12	8	100	45	0.62	20.81						
13	2	50	135	0.62	44.87						
14	8	50	135	0.62	91.44						
15	2	100	135	0.62	24.17						
16	8	100	135	0.62	54.94						

**ตารางที่ 4.4** ผลของการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับต่อประสิทธิภาพ ในการขจัดฟีนอล

การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง Normal probability กับค่าประมาณปัจจัย ตารางแสดงการคำนวณคอนแทรสต์จากระดับสูงสุด (+) และระดับต่ำสุด (-) ของแต่ละปัจจัยใน การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับแสดงในภาคผนวก ค จากคอนแทรสต์ที่ได้ นำไปหาค่าประมาณปัจจัยแฟกทอเรียลจำนวน 15 ปัจจัยและผลรวมกำลังสอง

รูปที่ 4.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Normal probability กับค่าประมาณปัจจัย โดย จุดข้อมูลของปัจจัยใดที่อยู่บนเส้นตรงถือว่าไม่มีนัยสำคัญ แต่จุดข้อมูลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ระบบจะอยู่นอกเส้นตรง จากผลการคำนวณพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอล คือ ปัจจัยหลัก ได้แก่ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ (A) ความ เข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอล (B) กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต (C) และความเข้มข้นของไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (D) และอันตรกิริยาของสองปัจจัย ได้แก่ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบ ไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต (AC) และความเข้มข้นเริ่มต้น ของฟืนอลร่วมกับกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต (BC)



**รูปที่ 4.12** ความส้มพันธ์ระหว่าง Normal probability กับค่าประมาณปัจจัยต่อประสิทธิภาพใน การขจัดฟื่นอล

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ต่อประสิทธิภาพในการ ขจัดฟืนอล พบว่าคอลัมน์ที่แสดงร้อยละการกระจายตัว (Percent contribution) ทำนาย ความสำคัญของปัจจัยสำคัญที่ได้จากรูปที่ 4.5 หารด้วยผลรวมทั้งหมดกำลังสอง การทดสอบ F ใช้ ประมาณค่าเมื่อปัจจัยนั้นมีผลเป็นนัยสำคัญ ( $F_0 > F_{\alpha,v_1,v_2}$  เมื่อ  $\alpha$  คือ 95% หรือ 0.05  $v_1$  คือ ระดับการสุ่มแบบจำลอง และ  $v_2$  คือระดับการสุ่มปัจจัยที่ไม่มีนัยสำคัญหรือความคลาดเคลื่อน) ค่า F ของแต่ละแบบจำลองและปัจจัยได้จากตารางร้อยละการกระจายตัวของ F (Appendix Table IV in Montgomery, 2001) ยกตัวอย่างค่า F ของการขจัดฟืนอล (%) ( $F_{0.05,6.9}$ ) เท่ากับ 3.37 น้อยกว่า  $F_0$  (43.02) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าแบบจำลองการขจัดฟืนอล (%) มีนัยสำคัญ วิธีนี้ใช้ ตรวจสอบความจริงแบบจำลองทั้งหมดและปัจจัยที่เลือกที่มีนัยสำคัญแสดงในตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 แสดงผลที่ได้จากการคำนวณการประมาณผลและการประมาณสัมประสิทธิ์ กับความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน จะเห็นได้ว่าการเพิ่มจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบ ด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์มีผลในแง่บวกต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล เนื่องจากการเพิ่ม

ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ <mark>ความแ</mark> บ	ปร <sub>ั</sub> ปรวนของการออกแบบการทด	เลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสอง
ระดับจำนวน 4 ปัจจั	ខ	

แบบจำลอง	ผลรวม ร้อยละการ กำลังสอง กระจายตัว		ตัวแปร อิสระ	ค่าเฉลี่ย กำลังสอง	F <sub>0</sub>	F <sub>α,ν1,ν2</sub> (จากตาราง)
ระดับการขจัดฟีนอล (%)			Ĥ			F <sub>0.05,6,9</sub>
แบบจำลอง	8684.48	96.63	6	1447.41	43.02	3.37
						F <sub>0.05,1,9</sub>
А	2764.13	30.75	1	2764.13	82.15 45.73	5.12
В	1538.60	17.12	1	1538.60		5.12
С	3229.65	35.93	1	3229.65	95.98	5.12
D	563.83	6.27	1	563.83	16.76	5.12
AC	298.43	3.32	1	298.43	8.87	5.12
BC	289.85	3.22	1	289.85	8.61	5.12
ความคลาดเคลื่อน	302.84	3.36	9	33.65		
ผลรวม	8987.32		15			

64

**ตารางที่ 4.6** การคำนวณค่าประมาณปัจจัย ค่าประมาณสัมประสิทธิ์และค่าความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลต่อประสิทธิภาพในการ ขจัดฟีนอล

ชื่อปัจจัย	ค่าประมาณ	± ความคลาด	ค่าประมาณ ± ความคลาด		
	ปัจจัย	เคลื่อน	สัมประสิทธิ์	เคลื่อน	
ระดับการขจัดฟีนอล (%)			32.03 ±	1.45	
ปัจจัยหลัก					
จำนวนแผ่น PMMA/TiO <sub>2</sub> (A)	26.29	$9 \pm 2.90$	13.14 <del>1</del>	1.45	
ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล (B)	-19.6	1 ± 2.90	-9.81 ±	1.45	
กำลังของหลอดยูวี (C)	28.42	$2 \pm 2.90$	14.21 <del>1</del>	1.45	
ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเป <mark>อร์ออกไซด์ (D)</mark>	11.87	7 ± 2.90	$5.94 \pm 1.45$		
อันตรกิริยาของสองปัจจัย					
จำนวนแผ่น PMMA/TiO₂ร่วมกับกำลังของ	8.64	± 2.90	4.32 ±	1.45	
หลอดยูวี (AC)					
ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลร่ <mark>วมกับ</mark> กำลัง	-8.51	1 ± 2.90	-4.26 ±	1.45	
ของหลอดยูวี (BC)					

จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นการเพิ่มจำนวน active sites ในการเกิดปฏิกิริยา หรืออาจกล่าวได้ว่าความหนาแน่นของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อพื้นที่การฉาย แสงมากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอลสูงขึ้น (Noorgahan และคณะ, 2003) นอกจากนี้การเพิ่มจำนวนไทเทเนียมไดออกไซด์ยังเป็นการลดการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนกับ หลุมเพื่อทำปฏิกิริยาดูดซับตัวรองรับบนพื้นผิวได้เร็วขึ้น (Jung และคณะ, 1999, Lathasree และ คณะ, 2004, Yung และคณะ, 2004)

การเพิ่มความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลมีผลในแง่ลบต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล เนื่องจากประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลขึ้นอยู่กับอนุมูลไฮดรอกซิลบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา และความเป็นไปได้ของอนุมูลไฮดรอกซิลในการทำปฏิกิริยากับฟีนอล เมื่อความเข้มข้นของฟีนอลใน สารละลายมีค่าสูง ทำให้ประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลของไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลงเพราะฟี นอลจะเข้ามาดูดซับที่ผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณมาก ทำให้อนุมูลไฮดรอกซิลบนพื้นผิว ของไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลงและแสงไม่สามารถเข้าถึงผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งการอิ่มตัวที่ ผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์มีผลทำให้ไทเทเนียมไดออกไซด์เฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยา(Arana และ คณะ, 2004)

กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตมีผลในแง่บวกต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟื่นอล เนื่องจากการเพิ่มกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต ลดการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนกับหลุม จึงทำ ให้ประสิทธิภาพในการขจัดฟื่นอลเพิ่มขึ้นที่กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตมากขึ้น (Chiou และ คณะ, 2008)

การเพิ่มปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีผลในแง่บวกต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำให้เกิดการกระจายตัวของอนุมูลไฮดรอกซิลที่ใช้ในการออกซิไดซ์ บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาและเกิดการรวมตัวกับอิเล็กตรอนในแถบการนำซึ่งเป็นการลดการ รวมตัวของอิเล็กตรอนกับหลุม ทำให้อนุมูลไฮดรอกซิลในระบบสูงขึ้น ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขจัดฟีนอล(Edwars และคณะ, 1982)

#### 4.4.1 สมการถดถอย (Regreesion model)

จากการวิเคราะห์ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ของปัจจัยสำคัญ 4 ตัวต่อประสิทธิภาพในการ ขจัดฟีนอลตามตารางที่ 4.6 สามารถนำมาใช้เป็นสัมประสิทธิ์ในสมการถดถอย ในงานวิจัยนี้เพื่อ ใช้ทำนายประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลดังแสดงในสมการ 4.23 และ 4.24

$$Y = 32.03 + 13.14A - 9.81B + 14.21C + 5.94D + 4.32AC - 4.26BC$$
(4.23)

$$\hat{\mathbf{Y}} = -5.95 + 1.50a - 0.05b + 0.44c + 118.73d + 0.03ac - (3.78 \times 10^{-3})bc$$
(4.24)

เมื่อ  $\stackrel{\wedge}{\mathrm{Y}}$  แทนประสิทธิภาพในการขจัดฟื่นอล

Λ

- A B C และ D แทนสัญลักษณ์ทางสถิติ ((-1) หรือ (+1)) ของตัวแปร ได้แก่ จำนวนแผ่น พอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ความเข้มข้น เริ่มต้นของฟีนอล กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต และความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตามลำดับ
- a b c และ d แทนค่าจริงที่ใช้ในการทดลองของตัวแปร ได้แก่ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเม ทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต และความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ตามลำดับ

สมการถดถอยสามารถใช้ในการทำนายผลการทดลองในการออกแบบการทดลองเซิงแฟก ทอเรียลสองระดับได้

### 4.4.2 ผลตกค้างและการตรวจสอบความถูกต้อง

การตรวจสอบสมการถดถอยที่ใช้ทำนายระดับการขจัดฟืนอลที่ได้จากการออกแบบเชิง แฟกทอเรียลสองระดับ ดังสมการที่ 4.23 พบว่าเมื่อให้ปัจจัยทุกตัวอยู่ในระดับต่ำ (-1) ค่าทำนาย ต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอ<mark>ลคำนวณตามสมการ 4.25</mark>

 $\hat{\mathbf{Y}} = 32.03 + 13.14(-1) - 9.81(-1) + 14.21(-1) + 5.94(-1) + 4.32(-1\times-1) - 4.26(-1\times-1)$ (4.25) = 8.61

แต่ค่าจริง (Y) เท่ากับ 9.71 ดังนั้นผลตกค้าง (residual, e) เท่ากับ 1.10 นอกจากนี้ค่าจริง ค่าทำนายและผลตกค้างทั้ง 16 การทดลองแสดงดังตารางที่ 4.7

รูปที่ 4.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Normal probability กับผลตกค้างต่อ ประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอล จุดข้อมูลของแต่ละการทดลองที่ได้จาการออกแบบเชิงแฟกทอ เรียลจะอยู่ใกล้เส้นตรง ดังนั้นผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยหลัก คือ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเม ทาคริเลตที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ (A) ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอล (B) กำลังของหลอดอัล ตราไวโอเล็ต (C) ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (D) อันตรกิริยาของสองปัจจัย คือ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับกำลังของหลอดอัลตราไว โอเล็ต (AC) และความเข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอลร่วมกับกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต (BC) มี นัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอลจากผลของการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการขจัดฟื่นอลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ แบบจำลองโดยการพล็อตผลตกค้างกับค่าทำนายฟื่นอลที่ถูกขจัด (%) ความสัมพันธ์ระหว่างผล ตกค้างกับฟื่นอลที่ถูกขจัด (%) แสดงในรูป 4.14 ซึ่งกราฟที่ได้มีการกระจายข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบที่ แน่นอนหรือไม่มีโครงสร้าง

ครั้งที่	เครื่องหมาย		(%)	
	_	ค่าจริง	ค่าทำนาย	ผลตกค้าง
1	(1)	9.71	8.61	1.10
2	а	24.15	26.26	-2.11
3	b	4.21	-2.49	6.70
4	ab	16.20	15.16	1.04
5	с	35.85	36.90	-1.05
6	ac	69.03	71.82	-2.79
7	bc	10.20	8.77	1.43
8	abc	39.38	43.70	-4.38
9	d	14.20	20.48	-6.28
10	ad	45.42	38.13	7.29
11	bd	7.86	9.38	-1.52
12	abd	20.81	27.03	-6.22
13	cd	44.87	48.77	-3.90
14	acd	91.44	83.70	7.74
15	bcd	24.17	20.65	3.52
16	abcd	54.94	55.57	-0.63

ตารางที่ 4.7 ค่าจริง ค่าทำนายและผลตกค้างต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟื่นอล

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



**รูปที่ 4.13** ความสัมพันธ์ระหว่าง Normal probability กับผลตกค้างต่อประสิทธิภาพในการ ขจัดฟีนอล



รูปที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตกค้างกับค่าทำนายต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล

## 4.5 ผลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อระดับการขจัดของฟีนอล

รูปที่ 4.15ก แสดงผลของจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ ต่อระดับการขจัดฟีนอล (%) ที่ได้จากการทดลอง จะเห็นได้ว่าระดับการขจัดฟีนอลเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่ม จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ เนื่องจากการเพิ่มจำนวน แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นการเพิ่มจำนวน active sites ใน การเกิดปฏิกิริยา หรืออาจกล่าวได้ว่าความหนาแน่นของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อพื้นที่การฉายแสงมาก ขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกำจัดฟีนอลสูงขึ้น (Noorgahan และคณะ, 2003) นอกจากนี้การ เพิ่มจำนวนไทเทเนียมไดออกไซด์ยังเป็นการลดการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนกับหลุมเพื่อทำ ปฏิกิริยาดูดซับตัวรองรับบนพื้นผิวได้เร็วขึ้น (Jung และคณะ, 1999, Lathasree และคณะ, 2004, Yung และคณะ, 2004) ส่วนผลที่ได้จากการคำนวณตามสมการถดถอย จะเห็นได้ว่าระดับการ ขจัดฟีนอลเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่ง สอดคล้องกับผลที่ได้จากการทดลอง

รูปที่ 4.15ข แสดงผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอลต่อระดับการขจัดฟืนอล (%) ที่ได้ จากการทดลอง จะเห็นได้ว่าระดับการขจัดฟืนอลลดลงเมื่อเพิ่มความเข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอล เนื่องจากประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอลขึ้นอยู่กับอนุมูลไฮดรอกซิลบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา และความเป็นไปได้ของอนุมูลไฮดรอกซิลในการทำปฏิกิริยากับฟืนอล เมื่อความเข้มข้นของฟืนอลใน สารละลายมีค่าสูง ทำให้ประสิทธิภาพในการขจัดฟืนอลของไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลง เพราะฟืนอลจะเข้ามาดูดซับที่ผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณมาก ทำให้อนุมูลไฮดรอก ซิลบนพื้นผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลงและแสงไม่สามารถเข้าถึงผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งการอิ่มตัวที่ผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์มีผลทำให้ไทเทเนียมไดออกไซด์เลื่อยต่อการทำปฏิกิริยา ลง (Arana และคณะ, 2004) ส่วนผลที่ได้จากการคำนวณตามสมการถดถอย จะเห็นได้ว่าระดับ การขจัดฟืนอลลดลงเมื่อเพิ่มความเข้มข้นเริ่มต้นของฟินอลซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการทดลอง

รูปที่ 4.15ค แสดงผลของกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตต่อระดับการขจัดฟีนอล (%) ที่ได้จากการทดลอง จะเห็นได้ว่าระดับการขจัดฟีนอลเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มกำลังของหลอดอัลตราไวโอ เล็ตเนื่องจากการเพิ่มกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต ลดการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนกับหลุม จึง ทำให้อัตราการสลายฟีนอลเพิ่มขึ้นที่กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตมากขึ้น (Chiou และคณะ, 2008) ส่วนผลที่ได้จากการคำนวณตามสมการถดถอย จะเห็นได้ว่าระดับการขจัดฟีนอลเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการทดลอง รูปที่ 4.15ง แสดงผลของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อระดับการขจัดฟีนอล (%) ที่ได้จากผลการทดลอง จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จาก 0 ถึง 0.62 โมลาร์ เนื่องจากการปรับปรุงความว่องไวของไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยการเติมไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ในช่วงความเข้มข้นถึง 0.62 โมลาร์ ทำให้เกิดการกระจายตัวของอนุมูลไฮดรอกซิลที่ ใช้ในการออกซิไดซ์และเกิดการรวมตัวกับอิเล็กตรอนในแถบการนำซึ่งเป็นลดการรวมตัวของ อิเล็กตรอนกับหลุม ทำให้ปริมาณอนุมูลไฮดรอกซิลในระบบสูงขึ้น ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขจัดฟีนอลได้มากขึ้น (Edwars และคณะ, 1982) ส่วนผลที่ได้จากการคำนวณตามสมการ ถดถอย จะเห็นได้ว่าระดับการขจัดฟีนอลเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการทดลอง



**รูปที่ 4.15** ผลจากการคำนวณจากสมการถดถอยกับข้อมูลจากการทดลอง

## 4.6 การทดสอบจำนวนรอบการใช้งานของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วย ไทเทเนียมไดออกไซด์และจำนวนรอบของกระบวนการออกซิเดชันเชิงแสงในการลด ปริมาณฟีนอล

การทดสอบจำนวนรอบการใช้งานของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมได ออกไซด์เป็นการยืนยันความสามารถในการนำแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมได ออกไซด์กลับมาใช้ใหม่ โดยภาวะที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ที่ 30 ± 1°ซ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ที่ค่าความเป็น กรด-เบสของสารละลายเท่ากับ 5 ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอลที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 50 พีพี เอ็ม แสดงดังรูปที่ 4.16 พบว่าความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงของไทเทเนียม ไดออกไซด์บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตในการขจัดฟืนอลลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อใช้งานหลาย ครั้งโดยเมื่อผ่านไป 5 รอบ ค่าคงที่ปรากฏลดลงเพียง 1.1×10<sup>-3</sup> นาที<sup>-1</sup> เนื่องจากไทเทเนียมไดออกไซด์



ร**ูปที่ 4.16** จำนวนรอบในการใช้งานของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมได ออกไซด์ต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในการขจัดฟืนอล (จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ = 8 แผ่น ความ เข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอล = 50 พีพีเอ็ม ค่า pH เริ่มต้น = 5 กำลังของหลอดยูวี = 135 วัตต์ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส)

มีสมบัติทางกายภาพดังนี้ คือ มีความเสถียรสูง มีความสามารถในการละลายต่ำ ทนต่อการกัด กร่อน และเมื่อผ่านการใช้งานแล้วสามารถนำกลับมาใช้ในปฏิกิริยาใหม่ได้อีก (Hu และคณะ, 2005)

เมื่อนำสารละลายฟีนอลที่ผ่านการออกซิเดชันเชิงแสงในรอบแรกมาเป็นสารตั้งต้นในการทำ ปฏิกิริยาอีกครั้ง โดยควบคุมให้ภาวะที่ใช้ในการทดลองเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแผ่นพอลิเมทิลเม ทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ทุกรอบ ดังแสดงในรูปที่ 4.17 พบว่าในการนำ สารละลายฟีนอลที่ได้จากการทำปฏิกิริยาในรอบแรกมาทำปฏิกิริยาซ้ำหลายครั้งโดยใช้ตัวเร่ง ปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตใหม่ สามารถขจัดฟีนอลได้สูงสุด 98% เมื่อใช้จำนวนรอบในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 3 รอบ แสดงว่าสารละลายที่มีฟีนอลน้อยลงจะมี ประสิทธิภาพในการถูกออกซิไดซ์ได้ดีขึ้น



**รูปที่ 4.17** จำนวนรอบของกระบวนการออกซิเดชันเซิงแสงในการลดปริมาณฟีนอล (จำนวน แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ = 8 แผ่น ความเข้มข้น เริ่มต้นของฟีนอล = 50 พีพีเอ็ม ค่า pH เริ่มต้น = 5 กำลังของหลอดยูวี = 135 วัตต์ที่ 30 ± 1 องศาเซลเซียส)

## บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 ผลของอัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์และจำนวน รอบในการเคลือบต่อลักษณะและประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล

การยึดเกาะของไทเทเนียมไดออกไซด์บนพอลิเมทิลเมทาคริเลตขึ้นกับอัตราส่วนโดยโมลของ แอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์ (ACA/TiO<sub>2</sub>) โดยการเพิ่ม ACA/TiO<sub>2</sub> ทำให้ฟิล์มบาง ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้มีความเรียบและเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นเนื่องจากแอซีทิลอะซี โตนช่วยเพิ่มความมีขั้วและการเกาะติดบนผิวของพอลิเมอร์ ส่วนจำนวนรอบในการจุ่มเคลือบ สารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตต่อปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์ บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต พบว่าจำนวนรอบในการเคลือบ 1 และ 3 รอบ ส่งผลให้ฟิล์มบาง ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้มีความเรียบและเป็นเนื้อเดียวกัน แต่เมื่อเพิ่มจำนวนรอบในการ เคลือบเป็น 5 และ 10 รอบ ส่งผลให้ฟิล์มบางที่เตรียมได้มีรอยแตกและรูพรุนเกิดขึ้นบนผิวของฟิล์ม ทั้งนี้อาจเกิดจากการระเหยของตัวทำละลายและแอซีทิลอะซีโตน

ผลของอัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์และจำนวน รอบในการจุ่มเคลือบสารละลายไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล พบว่า การเพิ่มอัตราส่วนของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ ขจัดฟีนอลเพิ่มขึ้น อัตราส่วนโดยโมลของแอซีทิลอะซีโตนต่อไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 3.0 ให้ ประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล 62.5% ทั้งนี้เนื่องมาจากแอซีทิลอะซีโตนช่วยเพิ่มความมีขั้วของ ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ไปยังผิวของพอลิเมทิลเมทาคริเลตทำให้ไทเทเนียมเกาะติดบนผิว ของพอลิเมทิลเมทาคริเลตมากขึ้น สำหรับผลของจำนวนรอบในการเคลือบสารละลายไทเทเนียม ไดออกไซด์บนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่ ACA/TiO<sub>2</sub> เท่ากับ 3.0 พบว่าจำนวนรอบในการจุ่ม เคลือบมากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณไทเทเนียมได ออกไซด์บนตัวรองรับมากขึ้นเมื่อความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้น และพบว่าจำนวนรอบในการจุ่ม เคลือบเท่ากับ 5 รอบ มีประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลได้มากที่สุดถึง 68.5% 5.1.2 ผลของอุณหภูมิในการเผาไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล

รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของไทเทเนียมไดออกไซด์ก่อนและหลังผ่านการเผาที่ อุณหภูมิในช่วง 400-800 องศาเซลเซียส พบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ก่อนการเผาและหลังการเผา ที่อุณหภูมิ 400-800 องศาเซลเซียส มีโครงสร้างผลึกแบบผสมระหว่างสัณฐานแบบอนาเทสและรู ไทล์ในอัตราส่วนที่แตกต่าง ส่วนระดับการสลายฟีนอลที่ 5 ชั่วโมง พบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ Degussa P-25 ประกอบด้วยสัณฐานแบบอนาเทส/รูไทล์เท่ากับ 70/30 โดยน้ำหนัก เมื่อเผา ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงถึง 700 องศาเซลเซียสทำให้สัณฐานแบบอนาเทสเปลี่ยนไป เป็นรูไทล์ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความว่องไวต่ำกว่าแบบอนาเทส โดยระดับการสลายฟีนอลของ ไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลง 23.4% ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส

5.1.3 ผลของจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ต่ออัตรา การสลายตัวของฟีนอล

ผลของจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสง พบว่าอัตราการสลายฟีนอลเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มจำนวนแผ่นเมทิลเมทาคริเลตที่ เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นการเพิ่มจำนวน active sites ในการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น หรือ อาจกล่าวได้ว่าความหนาแน่นของตัวเร่งปฏิกิริยาต่อพื้นที่การฉายแสงมากขึ้นส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลสูงขึ้น

### 5.1.4 ผลของค่าความเป็นกรด-เบสต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

แลของค่าความเป็นกรด-เบสต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง ของฟีนอล พบว่าเมื่อค่าความเป็นกรด-เบสสูงขึ้นช่วยเพิ่มอัตราการสลายฟีนอลสูงสุดในช่วงค่า ความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 5 เนื่องจากค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายเท่ากับ 5 ผิวของ ตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีประจุเป็นบวก ขณะที่ฟีนอลแตกตัวแล้วจะมีประจุเป็นลบ สามารถถูกดูดซับบน ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาได้ดี ประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลจึงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริเวณใกล้ผิวของ อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ มีค่าความหนาแน่นของอนุมูลไฮดรอกซิลมากที่สุดส่งผลให้ปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสงเกิดได้ดี

## 5.1.5 ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เชิงแสงของฟีนอล พบว่าอัตราการสลายฟีนอลลดลงเมื่อความเข้มข้นของฟีนอลเพิ่มขึ้น เนื่องจาก อัตราการสลายตัวขึ้นอยู่กับอนุมูลไฮดรอกซิลบนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาและความเป็นไปได้ของ อนุมูลไฮดรอกซิลในการทำปฏิกิริยากับฟีนอล ดังนั้นเมื่อความเข้มข้นของฟีนอลในสารละลายมีค่า สูง ทำให้ประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลของไทเทเนียมไดออกไซด์ลดลงเพราะฟีนอลจะเข้ามาดูด ซับที่ผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ในปริมาณมาก ทำให้อนุมูลไฮดรอกซิลบนพื้นผิวของไทเทเนียมได ออกไซด์ลดลงและแสงไม่สามารถเข้าถึงผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์

## 5.1.6 ผลของกำลั<mark>งของหลอดอัลตราไวโอเล็ตต่ออัต</mark>ราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตต่ออัตราการสลายตัวฟีนอลด้วยปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิง พบว่าค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงในการ กำจัดฟีนอลมีค่าเพิ่มขึ้นตามกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต เนื่องจากการเพิ่มกำลังของหลอดอัล ตราไวโอเล็ตช่วยเพิ่มอนุมูลไฮดรอกซิลเหมือนกับการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ลดการรวมตัวกัน ของอิเล็กตรอนกับหลุม จึงทำให้อัตราการสลายฟีนอลเพิ่มขึ้นที่กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต มากขึ้น

## 5.1.7 ผลของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการสลายตัว ของฟีนอลด้วยออกซิเดชันเชิงแสง พบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จาก 0 ถึง 0.62 โมลาร์ เนื่อจากการปรับปรุงความว่องไวของไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยการเติมไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ในช่วงความเข้มข้นถึง 0.62 โมลาร์ ทำให้เกิดการกระจายตัวของอนุมูลไฮดรอกซิลที่ ใช้ในการออกซิไดซ์และเกิดการรวมตัวกับอิเล็กตรอนในแถบการนำซึ่งเป็นลดการรวมตัวของ อิเล็กตรอนกับหลุม ทำให้ปริมาณอนุมูลไฮดรอกซิลในระบบสูงขึ้น

#### 5.1.8 ผลของอัตราการใหลของแก๊สออกซิเจนต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการสลายตัวของฟีนอล ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง พบว่าค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิง แสงในการสลายฟีนอลมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการไหลของออกซิเจนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการป้อน ออกซิเจนเข้าไปในระบบเป็นการเพิ่มปริมาณโมเลกุลออกซิเจนซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการรวมตัวกัน ของอิเล็กตรอนกับหลุม ผลสุดท้ายจะเกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิล ทำให้อัตราการสลายฟีนอลเพิ่มขึ้น

## 5.1.9 ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาต่ออัตราการสลายตัวของฟีนอล

ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาต่อค่าคงที่ปรากฏของอัตราการสลายตัวของฟันอลด้วย ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง พบว่าค่าคงที่ปรากฏของอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงใน การสลายฟันอลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น และค่าพลังงาน กระตุ้นของระบบเท่ากับ 0.01 กิโลจูลต่อโมล แสดงว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง ไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยในช่วง (20-80 องศาเซลเซียส) ผลของ อุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงอาจเกิดมาจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ไปยังออกซิเจนหรือในอีกแง่หนึ่ง คือ เกิดจากการคายซับอย่างรวดเร็วระหว่างตัวรองรับ (substrate) และตัวกลาง (intermediate) จากไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ดีที่อุณหภูมิสูง ทำให้มีพื้นที่ว่างในการ ทำปฏิกิริยามากขึ้นเป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงได้ดีขึ้น

5.1.10 การคำนวณทางสถิติโดยใช้การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลสองระดับ

ลำดับของปัจจัยหลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลโดยใช้การออกแบบการ ทดลองเชิงแฟกทอเรียลสองระดับมีดังนี้ กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ต > จำนวนแผ่นพอลิเมทิล เมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ > ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ > ความ เข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล ประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มกำลังของหลอดอัลตราไว โอเล็ต ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา และความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แต่เมื่อความเข้มข้น เริ่มต้นของฟีนอลเพิ่มขึ้นกลับทำให้ประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอลลดลง

## 5.1.11 ภาวะที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาออกซีเดชันเชิงแสง

จำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์เท่ากับ 8 แผ่น ความ เข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลเท่ากับ 50 พีพีเอ็ม ความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 5 ความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เท่ากับ 0.62 โมลาร์ กำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตเท่ากับ 135 วัตต์ อัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 200 มิลลิลิตรต่อนาที อุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส มีอัตราการสลายฟีนอลได้สูงสุดถึง 7.2×10<sup>-3</sup> นาที<sup>-1</sup> ซึ่งสามารถขจัดฟีนอลได้ 91.4%

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

- 5.2.1 ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริ เลตที่ได้สามารถประยุกต์ใช้ในการกำจัดอนุพันธ์ของฟีนอลิกตัวอื่นที่มีโครงสร้าง โมเลกุลที่ซับซ้อนมากขึ้น
- 5.2.2 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในการขจัดฟีนอลด้วย ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริเลต โดยมีการ ขยายส่วนของเครื่องปฏิกรณ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

คูนยวทยทรพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### รายการอ้างอิง

#### <u>ภาษาไทย</u>

ปรีชา พหลเทพ. (2549). <u>โพลิเมอร์</u>. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, กระทรวง. กรมควบคุมมลพิษ. กองจัดการสาร

้อันตรายและกากของเสีย. (2542)<mark>. ฟีนอ</mark>ล (phenol). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศรีเมือง.

#### <u>ภาษาอังกฤษ</u>

- Addamo, M., et. al. (2008). Photocatalytic thin films of TiO<sub>2</sub> formed by a sol–gel process using titanium tetraisopropoxide as the precursor. <u>Thin Solid Film</u> 516: 3802-3807.
- Ahmed, S., Rasul, M.G., Martens, W.N., Brown, R., and Hashib, M.A. (2010).
   Heterogeneous photocatalytic degradation of phenol in wastewater: A review on current status and developments. <u>Desalination</u> 261: 3-18.
- Arana, J., et. al. (2004). Photocatalytic degradation of formaldehyde containing wastewater from veterinatian laboratories. <u>Chemosphere</u> 55: 893-904.
- Baker, E.L., et. al. (1978). Phenol poisoning due to contaminated drinking water. <u>Arch</u> <u>Environ Health</u> 33: 89-94.
- Barbeni, M. Pramauro, E. Pelizzetti, E., Borgarello, E., and Serpone, N. (1985). Photodegradation of pentachlorophenol catalyzed by semiconductor particles. <u>Chemosphere</u> 14: 195-208.
- Carp, O., Huisman, C.L., and Reller, A. (2004). Photoinduced reactivity of titanium dioxide. <u>Progress in Solid State Chemistry</u> 32: 33-177.
- Cheng, S., Tsai, S.J., and Lee, Y.F. (1995). Photocatalytic decomposition of phenol over titanium dioxide of various structures. <u>Catalysis Today</u> 26: 87-96.
- Chiou, C.-H., Wu, C.-Y., and Juang, R.-S. (2008). Influence of operating parameters on photocatalytic degradation of phenol in UV/TiO<sub>2</sub> process. <u>Journal of Chemical Engineering</u> 139: 322-329.
- Chiou, C., and Juang, R. (2007). Photocatalytic degradation of phenol in aqueous solutions by Pr-doped TiO<sub>2</sub> nanopaticles. <u>Journal of Hazardous</u> 149: 1-7.

- Chun, H., Yizhong, W., and Aongxiao, T. (2000). Destruction of phenol aqueous solution by photocatalysis or direct photolysis. <u>Chemosphere</u> 41: 1205-1209.
- Clark, J. (2004). Assorted reactions of phenol [Online]. Available from: <u>http://www.chemguide.co.uk/organicprops/phenol/other.html</u>. [2010, February 5]
- Doong, R.A., Chen, C.H., Maithreepala, R.A., and Chang, S.M. (2001). The influence of pH and cadmium sulfide on photocatalytic degradation of 2-chlorophenol in titanium dioxide suspension. <u>Water Research</u> 35: 2873-2880.
- Edwars, J., and Curoi, R. (1982). (R. in : Strukul (Ed.), <u>Catalytic oxidation with  $H_2O_2$  as</u> <u>oxidation</u>. Kluwer, Dordrecht, The Netherlands.
- Fujishima, A., Hashimato, K., and Watanabe, T. (1999). <u>TiO<sub>2</sub> Photocatalysis:</u>
   <u>Fundamental and Applications</u>. Tokyo, Japan: BKC Inc.
- Fujishima, A., Rao, T.N., and Tryk, D.A. (2000). Titanium dioxide photocatalysis. <u>Journal</u> of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 1: 1–21.
- Fumihide, S., Shotaro, I., and Naoya, K. (2009). Photocatalytic decompositions of gaseous HCHO over thin films of anatase titanium oxide converted from amorphous in a heated air and in an aqueous solution of hydrogen peroxide. <u>Journal of Chemical Engineering</u> 148: 234-241.
- Hermann, J.-M. (1999). Heterogeneous photocatalysis: fundamentals and applications to the removal of various types of aqueous pollutants. <u>Catalysis Today</u> 53: 115-129.
- Hoffmann, M.R., Martin, S.T., Dhoi, W., and Bahnemann, D.W. (1995). Environmental applications of semiconductor photocatalysis. <u>Chemical Reviews</u> 95: 69-96.
- Horikoshi, S., Watanabe, N., Onishi, H., Hidaka, H., and Serpone, N. (2002).
   Photodecomposition of a nonylphenol polyethoxylate surfactant in a cylindrical photoreactor with TiO<sub>2</sub> immobilized fiberglass cloth. <u>Applied Catalysis B:</u> <u>Environmental</u> 37: 117.
- Hosseini, S.N., Borghei, S.M., Vossoughi, M., and Taghavinia, N. (2007). Immobilization of TiO<sub>2</sub> on perlite granules for photocatalytic degradation of phenol. <u>Applied</u> <u>Catalyst B</u> 74: 53.

- Hu, Y., and Yuan, C. (2005). Low-temperature preparation of photocatalytic  $TiO_2$  thin films from anatase sols. Journal of Crystal Growth 274: 563-568.
- Hu, Y., and Yuan, C. (2006). Low-temperature preparation of photocatalytic TiO<sub>2</sub> thin film on polymer substrates by direct depositon from anatase sol. <u>Journal of Materials</u> <u>Science and Technology</u> 22: 239.
- Ilisz, I., and Dombi, A. (1999). Investigation of the photodecomposition of phenol in near UV irradiated aqueous TiO<sub>2</sub> suspension II: Effect of charge trapping species on product distribution. <u>Applied Catalysis: General</u> 180: 35-45.
- Juan, K.D. (1984). The fundamental and practice for the removal of phenolic compounds in wastewater. Industrial Pollutant Prevention Control 3(3): 88.
- Jung, K.Y., and Park, S.B. (1999). Anatase-phase titania: preparation by embedding silica and photocatalytic activity for the decomposition of trichloroethylene. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 127: 117-122.
- Karches, M., et. al. (2002). Plasma-CVD-coated glass beads as photocatalyst for water decontamination. <u>Catalyst Today</u> 72: 267.
- Kazuya, I., Ren-De, S., Motoyuki, T., Ken, H., and Osamu, Y. (2003). Sol-gel-derived TiO<sub>2</sub>/poly(dimethylsiloxane) hybrid films and their photocatalytic activities. Journal of Physics and Chemistry of Solids 64: 507-513.
- Konstantinou, I.K., and Albanis, T.A. (2003). TiO<sub>2</sub>-assisted photocatalytic degradation of azo dyes in aqueous solution: kinetic and mechanistic investigations A review.
   <u>Applied Catalysis B: Environmental</u> 49: 1-14.
- Komann, C., Bahnemann, D.W., and Hoffmann, M.R. (1991). Algicidal and chemical effect of u.v. radiation of water containing humic substances. <u>Environmental Science Technology</u> 25: 494.
- Lathasree, S., Rao, A.N., Sivasankar, B., Sadasivam, V., and Rengaraj, K. (2004). Heterogeneous photocatalytic mineralization of phenols in aqueous solutions. Journal of Molecular Catalysis A: Chemistry 223: 101-105.

- Lee, J.C., Kim, M.S., and Kim, B.W. (2002). Removal of parquet dissolved in a photoreactor with  $TiO_2$  immobilized on the glass-tubes of UV lamps. <u>Water</u> <u>Research</u> 36: 1776.
- Litter, M.I. (1999). Heterogeneous photocatalysis transition metal ions in photocatalytic systems. <u>Applied Catalysis B : Environmental</u> 23: 89-114.
- Liu, S.Y., Yang, M.J., and Dan, Y. (2006). Study of performance of photocatalytic degradation organic pollutants of PMMA/TiO<sub>2</sub> composite particles. <u>Gaofenzi</u> <u>Cailiao Kexue Yu Gongcheng/Polymeric Materials Science and Engineering</u> 22: 93.
- Liu, S.X., Qu, Z.P., Han, X.W., and Sun, C.L. (2004). A mechanism for enhanced photocatalytic activity of silver-loaded titanium dioxide. <u>Catalysis Today</u> 95: 877–884.
- Mugglie, D.S., and Ding, L. (2001). Photocatalytic performance of sulfated  $TiO_2$  and Degussa P-25  $TiO_2$  during oxidation of organics. <u>Applied Catalysis B:</u> <u>Environmental</u>, 32, 181-188.
- Matthew, R.W. (1987). Photooxidation of organic impurities in water using thin films of titanium dioxide. Journal of Physical Chemistry 91: 3328-3333.
- Montgomery, D.C. (2001). <u>Design and Analysis of Experiments</u>. 5<sup>th</sup> ed. New York: John Wiley & Sons.
- Moza, D.N., Fytianos, K., Samanidou, V., and Korte, F. (1988). Photodecomposition of chlorophenols in aqueous medium in presence of hydrogen peroxide. <u>Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology</u> 41: 678.
- Murov, S.L., Carmichael, I., and Huy, G.L. (1993). <u>Handbook of photochemistry</u>. New York: Marcel Dekker.
- Naeem, K., and Ouyang, F. (2009). Preparation of Fe<sup>3+</sup>-doped TiO<sub>2</sub> nanoparticles and its photocatalytic activity under UV light. <u>Physical B: Condensed Matter</u> 405: 221-226.
- Noorjahan, M., Naeem, K., and Ouyang, F. (2009). Preparation of Fe<sup>3+</sup>-doped TiO<sub>2</sub> nanoparticles and its photocatalytic activity under UV light. <u>Physical B:</u> <u>Condensed Matter</u> 405: 221-226.

- Ollis, D.F., Pelizzetti, E., and Serpone, N. (1991). Destruction of water contaminants. <u>Environmental Science Technology</u> 25: 1522.
- Pratap, M., Durga Kumari, V., Lavedrine, B., Boule, D., and Subrahaman yam, M. (2003).
   Photocatalytic degradation of H-acid over a noval TiO<sub>2</sub> thin film fixed bed reactor and in aqueous suspension. <u>Journal of photochemistry and photobiology A:</u>
   <u>Chemistry</u> 156:179-187.
- Qamar, M., Saquib, M., and Muneer, M. (2005). Photocatalytic degradation of two selected dye derivation chromotrope 2B and amida 10 B in aqueous suspension of titanium dioxide. <u>Dyes and pigments 65</u>: 1-9.
- Rajeshwar, K. (1995). Photoelectrochemistry and the environment. <u>Journal of Applied</u> <u>Electrochemistry</u> 25: 1067-1082.
- Rengaraj, S., and Li, X.Z. (2006). Enhanced photocatalytic activity of TiO<sub>2</sub> by doping with Ag for degradation of 2,4,6-trichlorophenol in aqueous suspension. <u>Journal of Molecular Catalysis A: Chemical</u> 243: 60-67.
- Reutergardh, L.B., and langphasuk, M. (1997). Semiconductor photocatalysis : An environmentally acceptable alternative production technique and effluent treatment process. <u>Chemosphere</u> 35(3): 585-596.
- Reddy, S.S., and Kotaiah, B. (2006). The removal of composite reactive dye from dyeing unit effluent using sewage sluge derived activated carbon. <u>Journal of Energy</u> <u>Environmental Science</u> 30: 367-373.
- Robertson, P.K.J. (1996). Semiconductor photocatalysis: an environmentally acceptable alternative production technique and effluent treatment process. Journal of <u>Cleaner Production</u> 4(3-4): 203-212.
- Smith, J.V. (1960). X-ray Powder Data File. American Society for Testing Materials.
- Sauer, T., Cesconetoneto, G., Jose, H.J., and Moreira, R.F.P.M. (2002). Kinetic of photocatalytic degradation of reaction dyes in a TiO<sub>2</sub> slurry reactor. <u>Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry</u> 149:147-154.

- Shibaeva, I.V., Metelitsa, D.I., and Denison, E.T. (1969). The oxidation of phenol with molecular oxygen in aqueous solution II.The role of hydrogen in the oxidation of phenol with oxygen. <u>Kinetic Catalyst</u> 10: 1022.
- Sobczyn`shi, A., Duczmal, L., and Zmudzim`ski, W. (2002). Phenol destruction by photoctalysis on TiO<sub>2</sub>: an attempt to solve the reaction mechanism. <u>Journal of Molecular Catalysis A: Chemical</u> 13: 225-230.
- Sun, J., Qiao, L., Sun, S., and Wang, G. (2007). Photocatlytic degradation of Orange G on nitrogen-doped TiO<sub>2</sub> catalysts under visible light and sunlight irradiation. <u>Journal of Hazardous Materials</u>, In Press.
- Swarnalatha, B, and Anjaneyulu, Y. (2004). Studied on the heterogeneous photocatalytic oxidation of 2,6-dinitrophenol in aqueous TiO<sub>2</sub> suspension. <u>Journal of Molecular</u> <u>Catalysis A: Chemical</u> 223: 161-165.
- Wang, C.C., and Ying J. (1999). Sol-gel synthesis and hydrothermal processing of anatase and rutile titania nanocrystals. <u>Chemistry of Materials</u> 11: 3113-3120.
- Wei, T.Y. and Wan, C.C. (1991). Heterogeneous photocatalytic oxidation of phenol with titanium dioxide powders. <u>Industrial Chemistry Research</u> 30(6): 1294-1300.
- Xie, Y., Yuan, C. (2003). Photocatalytic activity and recycle application of titanium dioxide sol for X-3B photodegradation. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 206: 419-428.
- Yang, J.-H., Han, Y.-S., and Choy, J.-H. (2006). TiO<sub>2</sub> thin-films on polymer substrates and their photocatalytic activity. <u>Thin Solid Films</u> 495: 266-271.
- Yang, Y., Guo, Y., Hua, C., Wang, Y., and Wang, E. (2004). Preparation of surface modifications of mesoporous titania with monosubstituted Keggin units and their catalytic performance for organochlorine pesticide and dyes under UV irradiation. <u>Applied Catalysis A: General</u> 273: 201-210.
- Yu, J., and Zhao, X. (2000). Effect of substrates on the photocatalytic activity of nanometer TiO<sub>2</sub> thin films. <u>Materials Research Bulletin</u> 35: 1293-1301.

ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ภาคผนวก ก

## สเปกตรัมการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเล็ต

ตัวอย่างของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเล็ตที่ได้จากเครื่อง UV-VIS spectrophotometer ของสารละลายฟีนอล ณ เวลาใด ๆ



**รูปที่ ก1** สเปกตรัมการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเล็ตของสารละลายฟีนอล ณ เวลาใด ๆ (จำนวน แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ = 8 แผ่น ความเข้มข้น เริ่มต้นของฟีนอล = 50 พีพีเอ็ม และปริมาตรสารละลายฟีนอล = 500 มิลลิลิตร )

# จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ภาคผนวก ข

#### การคำนวณ

#### ข1. Calibration curve ของสารละลายฟีนอล

Calibration curve ของสารละลายฟีนอล โดยทดสอบค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย ฟีนอลที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ด้วยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นคงที่ที่ 269 นาโนเมตร

ความเข้มข้นของฟีนอล	ด่าการดดกลีบแสง					
(มิลลิกรัมต่อลิตร)						
0	0.0006					
1	0.0227					
2	0.0335					
3	0.0481					
4	0.0632					
5	0.0798					
6	0.0961					
8	0.1213					
10	0.1552					
20	0.3061					
40	0.6083					
60	0.9152					
80	1.2158					
100	1.5656					

**ตารางที่ ข1** ค่าการดูดกล<mark>ื่นแสงของสารละลายฟีนอลที่ความเข้ม</mark>ข้น 0-100 มิลลิกรัมต่อลิตร



**รูปที่ ข1** Calibration curve ของค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายฟีนอลที่ความเข้มข้น 0-100 มิลลิกรัมต่อลิตร

## ข2. ปริมาณฟีนอลที่ถู<mark>กขจัด</mark>

<u>ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริเลตร่วมกับ</u> <u>ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพในการขจัดฟีนอล</u>

ภาวะการทดลอง		
อุณหภูมิในการทดลองคงที่	30	องศาเซลเซียส
ปริมาณของสารละลายฟื่นอล	500	มิลลิลิตร
ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้	8	แผ่น
ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	0.62	โมลาร์

จากการทำ Calibration curve ของสารละลายฟีนอล โดยทดสอบค่าการดูดกลืนแสงของ สารละลายฟีนอลที่ความเข้มข้น 0-100 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยเครื่อง UV-VIS spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นคงที่ที่ 269 นาโนเมตร

## จะได้สมการดังนี้

- เมื่อ แทนค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายฟีนอล Y
  - แทนค่าความเข้มข้นของสารละลายฟีนอล Х

## จากตารางที่ ง5 ในภาคผนวก ง

**ตารางที่ ง**5 ผลของความเข้ม<mark>ข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไ</mark>ซด์ต่อประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลด้วย ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแ<mark>ส</mark>ง

ความเข้มข้น ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (โมลาร์)	เวลา (ชั่วโมง)	ค่าการดูดกลืนแสง	ความเข้มข้น (มิลลิกรัม/ลิตร)	การขจัด ฟีนอล (%)
0.62	0	0.9308	60.44	0
	1	0.6997	45.43	24.82
	2	0.4621	30.00	50.35
	3	0.2903	18.85	68.81
	4	0.1854	12.03	80.08
	5	0.0801	5.20	91.39

## 1.1 ความเข้มข้นของสารละลายฟีนอลเริ่มต้น

จากการแทนค่าการดูดกลื่นแสงในสมการ (ข1) จะได้ว่า

ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟืนอล	131	ค่าการดูดกลืนแสง 0.0154
	=	0.9308

60.44 มิลลิกรัม/ลิตร =

1.2 ความเข้มข้นของสารละลายฟีนอลหลังจากทำการทดลองขจัดเชิงแสง 5 ชั่วโมง

จากการแทนค่าการดูดกลื่นแสงในสมการ (ข1) จะได้ว่า

<u>ดการแข้งเข้งเของห์ไบดด</u>	_	0.0801			
N 9 19679 7870/ M 9 04		0.0154			
	=	5.20 มิลลิกรัม/ลิตร			

## 1.3 ปริมาณสารละลายฟีนอลที่ถูกขจัดภายหลังจากทำการทดลองขจัดเชิงแสง 5 ชั่วโมง

ฟีนอลที่ถูกขจัด = ความเข้มข้นฟีนอลเริ่มต้น - ความเข้มข้นฟีนอลที่เหลือ ความเข้มข้นฟีนอลเริ่มต้น × 100

## ข3. ค่าคงที่ปรากฏของอัตราการ<mark>เกิดปฏิกิริยาออก</mark>ซิเดชันเชิงแสงในการขจัดฟีนอล

จากสมการจลนพลศาสตร์ของแลงเมียร์-ฮินเชลวูด (Langmuir-Hinshelwood) แสดงดัง สมการ ข2

$$-\ln\left(\frac{C_{t}}{C_{0}}\right) = -k_{app}t \tag{22}$$

เมื่อ k<sub>app</sub> คือ ค่าคงที่ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาปรากฏของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเทียม (นาที<sup>-1</sup>)

C<sub>0</sub> คือ ความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอล (พีพีเอ็ม)

C, คือ ความเข้มข้นของฟื่นอล ณ เวลานั้น (พีพีเอ็ม)

เมื่อสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาและ –In (C<sub>t</sub>/C<sub>o</sub>) ความซันของ กราฟที่ได้ คือ ค่า k<sub>app</sub> แสดงดังรูปที่ ข2 พบว่าค่าคงที่ปรากฏเท่ากับ 7.2×10<sup>-3</sup> นาที<sup>-1</sup>

## จากตารางที่ ง5 ในภาคผนวก ง

**ตารางที่ ง5** ผลของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลด้วย ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

เวลา	ค่าการดูดกลื่นแสง	ความเข้มข้น	C/C <sub>0</sub>	-LN (C/C <sub>0</sub> )
(ชั่วโมง)		(มิลลิกรัม/ลิตร)		
0	0.9308	60.44	1	0
1	0.6997	45.43	0.75	0.28
2	0.4621	30.00	0.49	0.70
3	0.2903	18.85	0.31	1.16
4	0.1854	12.03	0.20	1.61
5	0.0801	5.20	0.08	2.45





## ภาคผนวก ค

## การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ

**ตารางที่ ค1** ค่าคงที่คอนแทรสต์ ค่าประมาณปัจจัยและผลรวมก<mark>ำลังสองของก</mark>ารข<mark>จัดฟีนอล (%) จาก</mark>การออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับจำนวน 4 ปัจจัย

การ	เครื่อง								ปัจ	จัยแฟคทอเรี	ยล						
ทดลอง	หมาย	А	В	AB	С	AC	BC	ABC	D	AD	BD	ABD	CD	ACD	BCD	ABCD	การขจัดฟีนอล (%) ที่ 5 ชม.
1	(1)	-1	-1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	1	9.71
2	а	1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	-1	24.15
3	b	-1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	4.21
4	ab	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	16.2
5	С	-1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	35.85
6	ac	1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1	69.03
7	bc	-1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	10.2
8	abc	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	39.38
9	d	-1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	14.2
10	ad	1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	45.42
11	bd	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	7.86
12	abd	1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	20.81
13	cd	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	44.87
14	acd	1	-1	-1	1	61	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	91.44
15	bcd	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	24.17
16	abcd	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	54.94
คอนแทรส	ต์	210.30	-156.90	-40.52	227.32	69.10	-68.10	0.92	94.98	32.72	-19.40	-27.62	26.94	-2.76	15.60	4.02	X = 32.03
ค่าประมา	าเป้จจัย	26.29	-19.61	-5.07	28.42	8.64	-8.51	0.12	11.87	4.09	-2.43	-3.45	3.37	-0.35	1.95	0.50	
ผลรวมกำเ	ลังสอง	2764.13	1538.60	102.62	3229.65	298.43	289.85	0.05	563.83	66.91	23.52	47.68	45.36	0.48	15.21	1.01	

88

## ภาคผนวก ง

## ประสิทธิภาพการขจัดฟีนอล

**ตารางที่ ง1** ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อประสิทธิภาพ การขจัดฟีนอลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

อุณหภูมิที่ใช้ใน	เวลา	ค่าการดูดกลื่นแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
การเผา TiO <sub>2</sub>	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
(องศาเซลเซียส)				
ไม่เผา	0	0.8547	55.50	0
	1	0.7089	46.03	17.05
	2	0.6061	39.35	29.08
	3	0.4832	31.37	43.46
	4	0.4071	26.08	53.60
	5	0.2690	17.46	68.52
400	0	0.8217	53.35	0
	1	0.7145	46.39	13.04
	2	0.6076	39.45	26.05
	3	0.5349	34.73	34.90
	4	0.4582	29.75	44.23
	5	0.4052	26.31	50.68
500	0	0.9468	53.29	0
	1	0.8152	45.72	14.21
	2	0.7145	38.33	28.07
	3	0.6020	31.86	40.21
	4	0.4870	25.70	51.77
	5	0.3947	19.99	62.48

อุณหภูมิที่ใช้ใน	เวลา	ค่าการดูดกลืนแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
การเผา TiO <sub>2</sub>	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
(องศาเซลเซียส)		sold the		
600	0	0.9340	60.64	0
	1	0.8532	55.40	8.65
	2	0.8126	52.76	12.99
	3	0.7946	51.59	14.92
	4	0.6852	44.49	26.63
	5	0.5960	38.70	36.18
700	0	0.8625	56.00	0
	1	0.8005	51.98	7.18
	2	0.7819	50.77	9.34
	3	0.7446	48.35	13.66
	4	0.7029	45.64	18.50
	5	0.6611	42.92	23.35

ตารางที่ ง1 (ต่อ) ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อ ประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนแผ่น	เวลา	ค่าการดูดกลืนแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
PMMA เคลือบ	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
TiO <sub>2</sub> (แผ่น)				
ยูวีอย่างเดียว	0	0.8083	52.48	0
	1	0.8036	52.18	0.58
	2	0.7948	51.61	1.67
	3	0.7919	51.42	2.02
	4	0.7783	50.53	3.71
	5	0.7658	49.72	5.25
2	0	0.8386	54.45	0
	1	0.7842	50.92	6.48
	2	0.7125	46.26	15.03
	3	0.6542	42.48	21.98
	4	0.5864	38.07	30.07
	5	0.5379	34.92	35.85
4	0	0.8453	54.88	0
	1	0.7621	49.48	9.84
	2	0.6829	44.34	19.21
	3	0.6001	38.96	29.00
	4	0.5449	35.38	35.53
	5	0.4689	30.44	44.52

ตารางที่ ง2	ผลของจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อ			
	ประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง			
จำนวนแผ่น PMMA เคลือบ TiO <sub>2</sub> (แผ่น)	เวลา (ชั่วโมง)	ค่าการดูดกลืนแสง (นาโนเมตร)	ความเข้มข้นของฟีนอล (มิลลิกรัม/ลิตร)	การขจัด ฟีนอล (%)
---	-------------------	--------------------------------	---	----------------------
6	0	0.8491	55.13	0
	1	0.7221	46.88	14.95
	2	0.6294	40.87	25.87
	3	0.5351	34.74	36.98
	4	0.4627	30.04	45.50
	5	0.3765	24.44	55.65
8	0	0.8208	53.29	0
	1	0.7041	45.72	19.99
	2	0.5904	38.33	28.07
	3	0.4907	31.86	40.21
	4	0.3958	25.70	51.77
	5	0.3079	19.99	62.48

#### **ตารางที่ ง2 (ต่อ)** ผลของจำนวนแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตต่อประสิทธิภาพการขจัดฟืนอลด้วย ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเข้มข้น	เวลา	ค่าการดูดกลืนแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
เริ่มต้นของฟีนอล	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
(พีพีเอ็ม)				
10	0	0.1552	10.07	0
	1	0.1027	6.66	33.82
	2	0.0949	6.16	38.85
	3	0.0790	5.12	49.09
	4	0.0589	3.82	62.04
	5	0.0347	2.25	77.64
50	0	0.8970	58.24	0
	1	0.7430	48.24	19.16
	2	0.6046	39.25	32.59
	3	0.5163	33.52	42.44
	4	0.3911	25.39	56.39
	5	0.2778	18.03	69.03
75	0	1.2319	79.99	0
	ลงโอ	1.1189	72.65	9.17
	2	0.9542	61.96	22.54
	3	0.8826	57.31	28.35
	4	0.7612	49.42	38.20
	5	0.6083	39.50	50.62

## ตารางที่ ง3 ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลต่อประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลด้วยปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสง

ความเข้มข้น เริ่มต้นของฟีนอล (พีพีเอ็ม)	เวลา (ชั่วโมง)	ค่าการดูดกลืนแสง (นาโนเมตร)	ความเข้มข้นของฟีนอล (มิลลิกรัม/ลิตร)	การขจัด ฟีนอล (%)
100	0	1.5363	99.75	0
	1	1.4340	93.11	6.65
	2	1.3107	85.11	14.68
	3	1.1759	76.35	23.45
	4	1.0524	68.33	31.49
	5	0.9312	60.46	39.38

### **ตารางที่ ง3 (ต่อ)** ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของฟีนอลต่อประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลด้วย ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

**ตารางที่ ง**4 ผลของค่าคว<mark>ามเป็นกรด-เบสของส</mark>ารล<mark>ะลายต่</mark>อประสิทธิภาพการขจัดฟื่นอลด้วย

ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

ค่าความเป็น	เวลา	ค่าการดูดกลืนแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
กรด-เบส	(ชั่วโ <mark>มง</mark> )	(นาโนเมตร)	(มิ <mark>ลลิ</mark> กรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
3	0	0.9053	58.78	0
	1	0.8228	53.42	9.11
	2	0.7108	46.15	21.48
	3	0.5690	36.94	37.14
	4	0.4715	30.61	47.91
	5	0.4135	26.85	54.32

ความเข้มข้น เริ่มต้นของฟีนอล	เวลา (ชั่วโมง)	ค่าการดูดกลืนแสง (นาโนเมตร)	ความเข้มข้นของฟีนอล (มิลลิกรัม/ลิตร)	การขจัด ฟีนอล (%)
(พีพีเอ็ม)				
5	0	0.8208	53.29	0
	1	0.7041	45.72	18.34
	2	0.5904	38.33	28.07
	3	0.4907	31.86	40.21
	4	0.3958	25.70	51.77
	5	0.2825	18.34	65.58
7	0	0.8988	58.36	0
	1	0.7814	50.74	13.06
	2	0.6574	42.68	26.85
	3	0.5503	35.73	38.77
	4	0.4543	29.50	49.45
	5	0.3710	24.09	58.72
9	0	0.8887	57.70	0
		0.8280	53.76	6.83
	2	0.7236	46.98	18.57
	3	0.6498	42.19	26.88
	4	0.5746	37.31	35.34
	5	0.4975	32.30	44.02

**ตารางที่ ง4(ต่อ)** ผลของค่าความเป็นกรด-เบสต่อประสิทธิภาพการขจัดฟืนอลด้วยปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสง

ความเข้มข้น	เวลา	ค่าการดูดกลืนแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
ไฮโดรเจนเปอร์	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
ออกไซด์ (โมลาร์)				
0.31	0	0.9323	60.53	0
	1	0.7636	49.58	18.09
	2	0.5598	36.35	39.95
	3	0.4715	30.61	49.42
	4	0.3185	20.68	65.83
	5	0.2162	14.03	76.81
0.62	0	0.9308	60.44	0
	1	0.6997	45.43	24.82
	2	0.4621	30.00	50.35
	3	0.2903	18.85	68.81
	4	0.1854	12.03	80.08
	5	0.0801	5.20	91.39
1.65	0	1.0430	67.72	0
	1	0.8072	52.41	22.60
	2	0.6364	41.32	38.98
	3	0.4150	26.94	60.21
	4	0.2389	15.51	77.09
	5	0.0963	6.25	90.76

**ตารางที่ ง5** ผลของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพการขจัดฟีนอล ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

ความเข้มข้น	เวลา	ค่าการดูดกลืนแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
ไฮโดรเจนเปอร์	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
ออกไซด์ (โมลาร์)				
3.13	0	1.2878	83.62	0
	1	1.0868	70.57	15.60
	2	0.8487	55.11	34.09
	3	0.6389	41.48	50.38
	4	0.4870	31.62	62.18
	5	0.2560	16.62	80.12
4.95	0	1.4750	95.77	0
	1	1.3116	85.16	11.07
	2	1.0771	69.94	26.97
	3	0.8235	53.47	44.16
	4	0.5854	38.10	60.31
	5	0.4462	28.97	69.74
6.26	0	1.6184	105.09	0
	1	1.4459	93.88	10.65
	2	1.2410	80.58	23.31
	3	0.9561	62.08	40.92
	4	0.7878	51.15	51.32
	5	0.6104	39.63	62.28

ตารางที่ ง5 (ต่อ)	ผลของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อประสิทธิภาพการขจัดฟื่นอล
	ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

กำลังของหลอดยูวี	เวลา	ค่าการดูดกลืนแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
(ວັຫຕ໌໌)	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
45	0	0.8517	55.30	0
	1	0.8149	52.91	4.32
	2	0.7674	49.83	9.89
	3	0.7353	47.74	13.66
	4	0.6859	44.53	19.46
	5	0.6460	41.94	24.15
99	0	0.7009	45.51	0
	1	0.6106	40.03	12.02
	2	0.5954	38.51	15.36
	3	0.5354	34.76	23.61
	4	0.4873	31.64	30.47
	5	0.4001	25.98	42.91
135	0	0.8208	53.29	0
	1	0.7041	45.72	14.21
	2	0.5904	38.33	28.07
	3	0.4907	31.86	40.21
	4	0.3958	25.70	51.77
	5	0.2825	18.34	65.58

#### **ตารางที่ ง6** ผลของกำลังของหลอดอัลตราไวโอเล็ตต่อประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลด้วยปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสง

ออกซิเจน	เวลา	ค่าการดูดกลืนแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
(มล./นาที)	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
0	0	0.8768	56.93	0
	1	0.7991	51.88	8.86
	2	0.7145	46.39	18.51
	3	0.6716	43.61	23.40
	4	0.6358	41.28	27.48
	5	0.5778	37.51	34.10
200	0	0.8208	53.29	0
	1	0.7041	45.72	14.21
	2	0.5904	38.33	28.07
	3	0.4907	31.86	40.21
	4	0.3958	25.70	51.77
	5	0.2825	18.34	65.58
400	0	0.9534	61.90	0
	1	0.8049	52.26	15.57
	2	0.6741	43.77	29.29
	3	0.5462	35.46	42.71
	4	0.4584	29.76	51.91
	5	0.3160	20.51	66.85

ตารางที่ ง7 ผลของอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนต่อประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลด้วยปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสง

ออกซิเจน	เวลา	ค่าการดูดกลื่นแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
(มล./นาที)	(ชั่วโมง)		(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
800	0	0.8533	55.40	0
	1	0.7210	46.81	15.50
	2	0.6263	40.66	26.60
	3	0.5184	33.66	39.24
	4	0.4154	26.97	51.31
	5	0.2949	19.14	65.44

ตารางที่ ง7 (ต่อ) ผลของอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนต่อประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลด้วย ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

ตารางที่ ง8 ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาต่อประสิทธิภาพการขจัดฟีนอลด้วยปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแสง

อุณหภูมิ	เวลา	ค่าการดูดกลื่นแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การจัด
(องศาเซลเซียส)	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
30	0	0.8970	58.24	0
	1	0.7430	48.24	17.16
	2	0.6046	39.25	32.59
	3	0.5163	33.52	42.44
	4	0.3911	25.39	56.39
	5	0.2778	18.03	69.03
40	0	0.8768	56.93	0
	1	0.7091	46.04	19.12
	2	0.6145	39.90	29.91
	3	0.4716	30.62	46.21
	4	0.3358	21.80	61.70
	5	0.2778	18.03	68.31

อุณหภูมิ	เวลา	ค่าการดูดกลื่นแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
(องศาเซลเซียส)	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
50	0	0.8517	55.30	0
	1	0.6408	41.61	24.76
	2	0.4826	31.33	43.33
	3	0.3763	24.43	55.81
	4	0.2953	19.17	65.32
	5	0.1578	10.24	81.47
60	0	0.9174	59.57	0
	1	0.6687	43.42	27.10
	2	0.5047	32.77	44.98
	3	0.3763	24.43	58.98
	4	0.3074	19.96	61.49
	5	0.1649	10.70	82.02
70	0	0.9174	59.57	0
	1	0.6408	41.61	30.15
	2	0.4826	31.33	47.39
	3	0.3763	24.43	58.98
	4	0.2953	19.17	67.81
	5	0.1498	9.72	83.67

ตารางที่ ง8 (ต่อ)	ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาต่อประสิทธิภาพการขจัดฟื่นอลด้วย
	ปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

จำนวนรอบ	เวลา	ค่าการดูดกลืนแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
1	0	0.8970	58.24	0
	1	0.7430	48.24	17.16
	2	0.6046	39.25	32.59
	3	0.5663	33.52	42.44
	4	0.3911	25.39	56.39
	5	0.2778	18.03	69.03
2	0	0.8118	52.17	0
	1	0.7016	45.55	13.57
	2	0.6019	39.08	25.85
	3	0.5019	32.76	38.17
	4	0.3968	25.76	51.12
	5	0.2979	19.34	63.30
3	0	0.8176	53.09	0
	1	0.7082	45.98	13.38
	2	0.5997	38.94	26.65
	3	0.5287	34.33	35.33
	4	0.4111	26.69	49.71
	5	0.3134	20.35	63.66

**ตารางที่ ง9** ผลของจำนวนรอบการใช้งานของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยไทเทเนียม ไดออกไซด์ต่อประสิทธิภาพการขจัดฟืนอลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง

#### ตารางที่ ง9(ต่อ) ผลของจำนวนรอบการใช้งานของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วย ไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อประสิทธิภาพการขจัดฟืนอลด้วยปฏิกิริยา ออกซิเดชันเชิงแลง

จำนวนรอบ	เวลา	ค่าการดูดกลืนแสง	ความเข้มข้นของฟีนอล	การขจัด
	(ชั่วโมง)	(นาโนเมตร)	(มิลลิกรัม/ลิตร)	ฟีนอล (%)
4	0	0.9063	58.85	0
	1	0.8203	53.26	9.48
	2	0.6458	41.93	28.74
	3 🥖	0.5869	38.11	35.24
	4	0.4759	30.90	47.48
	5	0.3879	25.18	57.19
5	0	0.9041	58.70	0
	1	0.8105	52.62	10.35
	2	0.6659	43.24	26.34
	3	0.6063	39.37	32.93
	4	0.4854	31.51	46.31
	5	0.4079	26.48	54.88

ิ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวฐนิสตา เลื่อนลอย เกิดวันที่ 7 เมษายน 2528 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยา ศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2550 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคนิค ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2551



# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย